

Zusammengefasster Lagebericht

der SÜSS MicroTec AG für das Geschäftsjahr 2015

Wirtschaftsbericht	34
-----	-----
Geschäftstätigkeit, Unternehmenssteuerung und strategische Ausrichtung	34
Wirtschaftliches Umfeld	37
SÜSS MicroTec in Zahlen	38
Ertragslage: Auftragseingang, Umsatz und EBIT	38
Entwicklung in den einzelnen Segmenten	40
Entwicklung in den wichtigsten Regionen	42
Finanz- und Vermögenslage	43
Investitionen	45
Forschung und Entwicklung	46
Die Holding – SÜSS MicroTec AG	49
Wesentliche Veränderungen der Vermögens- und Finanzlage	49
Wesentliche Ereignisse mit Einfluss auf die Ertragslage der Holding	50
Nachhaltigkeit	51
Compliance	51
Qualitätsmanagement	51
Umweltverantwortung	51
Mitarbeiter	53
Kundenbeziehungen	54

*Blick in die
ACS300 Gen2*

Übernahmerechtliche Angaben gemäß § 289 Abs. 4 HGB und § 315 Abs. 4 HGB	55
Erklärung zur Unternehmensführung gemäß § 289a HGB	57
Vergütungsbericht	61
Vergütung des Vorstands	61
Vergütung des Aufsichtsrats	66
Nachtragsbericht	67
Potenziale	67
Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung des SÜSS MicroTec-Konzerns	67
Chancen des Konzerns	67
Risikomanagement-System	71
Risiken des Konzerns	73
Gesamteinschätzung	78
Prognosebericht	79

Wirtschaftsbericht

Geschäftstätigkeit, Unternehmenssteuerung und strategische Ausrichtung

Der SÜSS MicroTec-Konzern entwickelt, fertigt und vertreibt Anlagen für die Herstellung von Mikroelektronik und Mikrosystemtechnik. Als Zulieferer von Systemlösungen für die Halbleitertechnik ist die Gruppe als leistungsstarker Partner der Halbleiter-Industrie für den Labor- und den Produktionsbereich tätig. Wachstumsstarke Spezialmärkte bilden die Tätigkeitsschwerpunkte und fördern die innovative Technologieentwicklung mit langfristigem Erfolgspotenzial für zukunftsorientierte Märkte und Anwendungen. Im Mittelpunkt steht die Aufbau- und Verbindungstechnik von Mikrochips bei Anwendungen in der Chipfertigung, der Telekommunikation und der optischen Datenübertragung. Größere Prozesslinien bestehen in der Regel aus mehreren Einzelgeräten, wobei die Gruppe mit internen und externen Partnern Netzwerke zur Schaffung von Wettbewerbsvorteilen bildet und nutzt.

Der Konzern ist zum 31. Dezember 2015 in vier Segmente eingeteilt, wobei das Segment „Sonstige“ aus mehreren kleineren Teileinheiten besteht, die jeweils getrennt geleitet werden. Durch die Akquisition der HamaTech APE GmbH & Co. KG (nach Umfirmierung: SÜSS MicroTec Photomask Equipment GmbH & Co. KG) wurde im Geschäftsjahr 2010 ein neues Segment – Fotomasken Equipment – geschaffen. Die im März 2012 akquirierte Tamarack Scientific Co., Inc. (nach Umfirmierung: SÜSS MicroTec Photonic Systems Inc.) ist im Segment Lithografie angesiedelt.

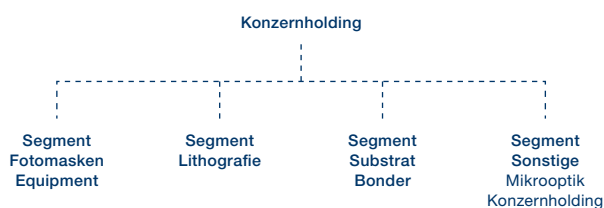
RECHTLICHE KONZERNSTRUKTUR

Die rechtliche Konzernstruktur besteht aus der Muttergesellschaft, der SÜSS MicroTec AG als Management- und Finanzierungsholding, sowie den mehrheitlich im Eigentum der Muttergesellschaft stehenden Tochtergesellschaften. In den Tochtergesellschaften sind jeweils Entwicklungs- und Produktionstätigkeiten oder auch lokale Vertriebs- und Servicetätigkeiten für den Konzern organisiert. Die Gruppe verfügt über Standorte in Deutschland, den USA, Großbritannien, Frankreich, der Schweiz, Japan, China, Singapur, Korea und Taiwan. Die geringfügige Beteiligung von 10 % an der ELECTRON-MEC S.R.L., Mailand (IT) wurde im Geschäftsjahr 2014 verkauft, da sie nur eine unwesentliche Bedeutung für das operative Geschäft hatte.

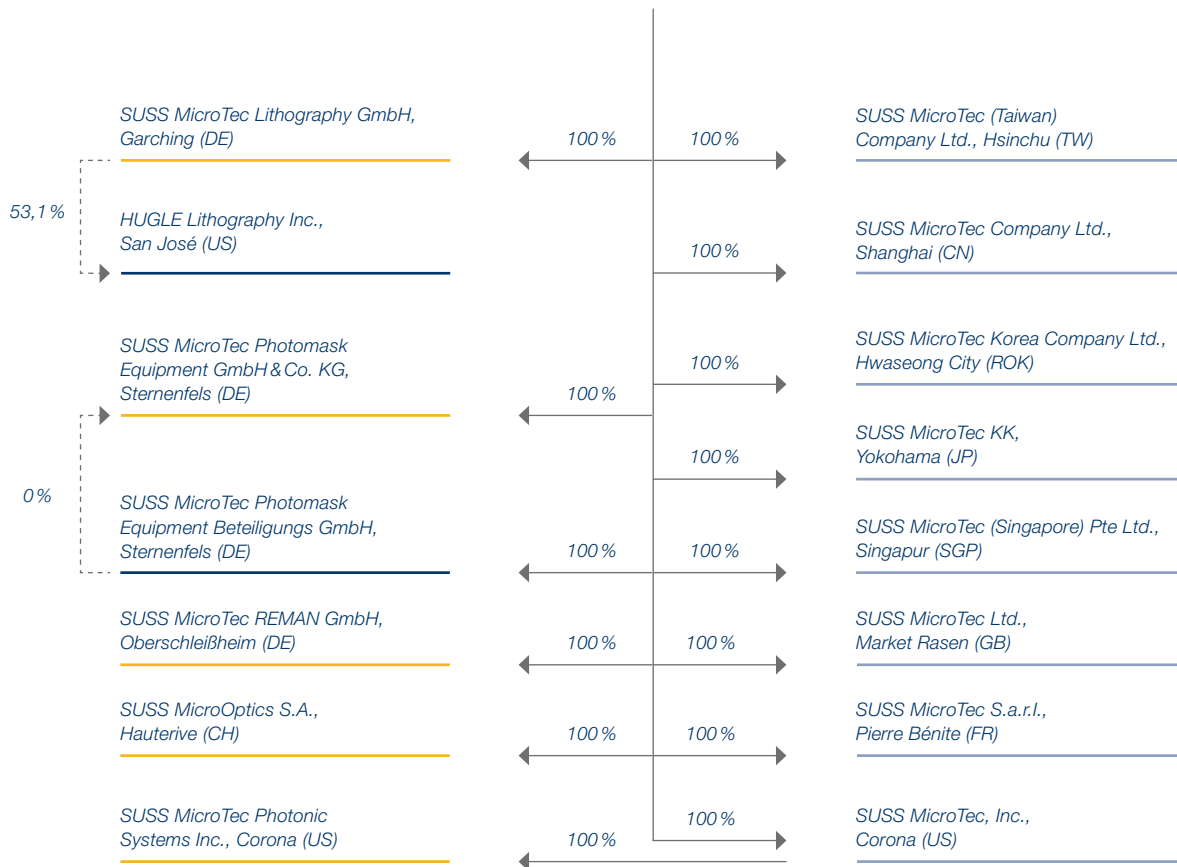
LEITUNG UND KONTROLLE – VERGÜTUNGSSTRUKTUR FÜR DIE ORGANMITGLIEDER

Der Vorstand erhält für seine Tätigkeit eine monatliche Festvergütung sowie eine variable Vergütung, die bei Erreichen individuell festgelegter Ziele gezahlt wird. In den Festbezügen enthalten sind Nebenleistungen in Form eines Dienstwagens mit privater Nutzungsmöglichkeit und Zuschüsse zur Krankenversicherung sowie zur freiwilligen Rentenversicherung. Die Höhe der Festbezüge wird in erster Linie von der übertragenen Funktion bzw. Verantwortung bestimmt. Einzelnen Mitgliedern des Vorstands sind zusätzlich Versorgungszusagen in Form von Direktversicherungen gemacht worden. Die variable Vergütung enthält kurzfristige und auch langfristige Komponenten, nähere Hinweise hierzu sind im Vergütungsbericht zu finden.

Segmentstruktur



SÜSS MICROTEC AG, GARCHING (DE)



Produktion

Vertrieb

Sonstige/Nonoperating

Die Vergütung des Aufsichtsrats ist in § 19 der Satzung der SÜSS MicroTec AG geregelt. Gemäß § 19 der Satzung erhalten die Mitglieder des Aufsichtsrats folgende Vergütung: Neben der Erstattung ihrer Auslagen und einem Sitzungsgeld von 2.000 € pro Sitzung erhält jedes Aufsichtsratsmitglied eine feste Vergütung, die sich an der Verantwortung und dem Tätigkeitsumfang der Aufsichtsratsmitglieder orientiert. Demnach erhält der Vorsitzende des Aufsichtsrats 60.000 €, sein Stellvertreter 50.000 € und ein einfaches Mitglied des Aufsichtsrats 45.000 € pro Geschäftsjahr als feste Vergütung.

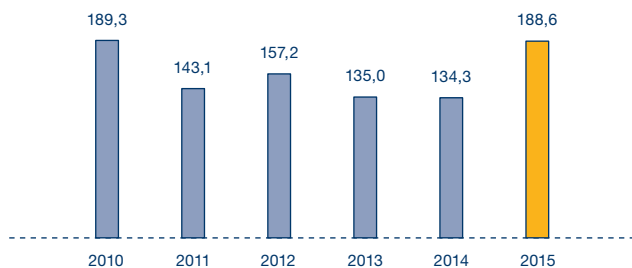
UNTERNEHMENSSTEUERUNG, ZIELE UND UNTERNEHMENSSTRATEGIE

SÜSS MicroTec verfolgt die Besetzung lukrativer Spezialmärkte in der Industrie der Halbleiterausruher als Strategie. Ziel ist es, durch eine klare Positionierung stets innerhalb der Top-3-Anbieter in den relevanten Märkten zu agieren. Partnerschaften mit führenden Instituten und Unternehmen der Industrie sollen sicherstellen, dass wesentliche Trends oder zukunftssträchtige Technologien stets rechtzeitig erkannt und auf deren Potenziale

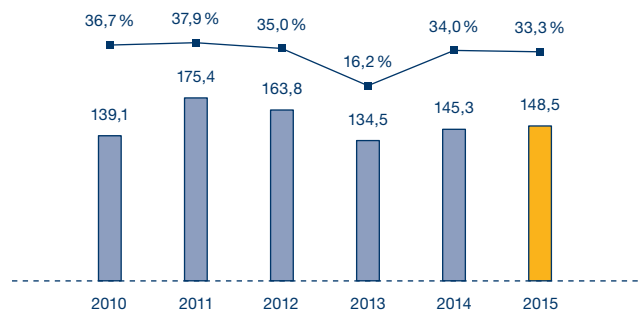
für SÜSS MicroTec überprüft werden. Im Vordergrund steht dabei organisches Wachstum; im Falle interessanter Technologien oder sinnvoller Komplementärprodukte wird auch externes Wachstum in Betracht gezogen.

Die Unternehmenssteuerung orientiert sich insbesondere am Auftragseingang, Umsatz und Auftragsbestand der einzelnen Segmente. Die Leistungsfähigkeit der Segmente wird dabei vor allem durch Beobachtung der Entwicklung der Rohertragsmarge (Umsatz abzüglich der Herstellungskosten) sowie des Segmentergebnisses gemessen. Die Darstellung des Segmentergebnisses enthält auch Erträge und Aufwendungen aus der Fremdwährungsumrechnung und aus Anlagenabgängen. In der Summe entsprechen die Ergebnisse der Segmente dem operativen Ergebnis (EBIT) des Konzerns. Weitere Steuerungskennzahl ist die Nettoliquidität (flüssige Mittel zuzüglich verzinslicher Wertpapiere und abzüglich Finanzschulden), die eine wesentliche Steuerungsgröße für die Finanzierungsfunktion der Holding darstellt. In der folgenden Darstellung sehen Sie die Entwicklung wichtiger Kennzahlen seit 2010.

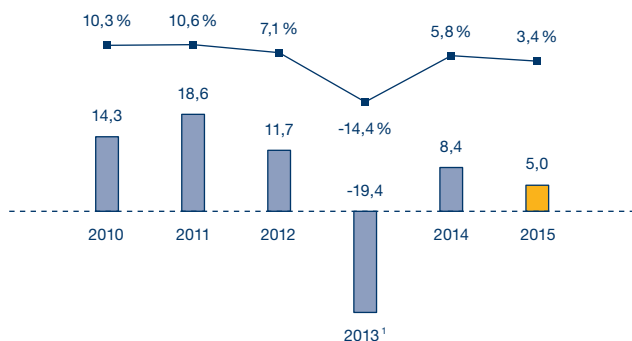
Auftragseingang in Mio. €



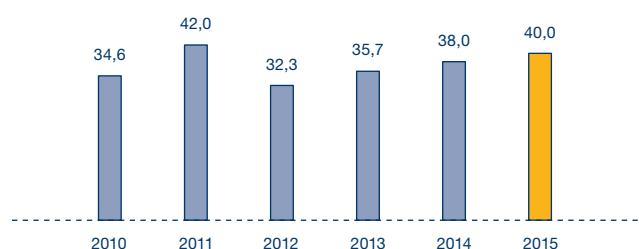
Umsatz in Mio. € und **Bruttomarge**



EBIT in Mio. € und **EBIT-Marge**



Nettoliquidität in Mio. €



¹ EBIT 2013 enthält Einmalkosten für die Refokussierung der Produktlinie permanente Bonder in Höhe von 13,2 Mio. €

Wirtschaftliches Umfeld

POLITISCHE UND HUMANITÄRE KRISEN PRÄGEN DAS WIRTSCHAFTSBILD IN EUROPA

In ihren aktuellsten Schätzungen erwartet die OECD ein leicht verlangsamtes globales Wirtschaftswachstum von rund 3,0 % für 2015, nach 3,3 % im Vorjahr. Die allgemein niedrigen Rohstoffpreise sowie insbesondere der geringe Ölpreis dämpften das Wachstum in den Schwellenländern. In den fortgeschrittenen Ländern hat sich der moderate Aufschwung erwartungsgemäß fortgesetzt.

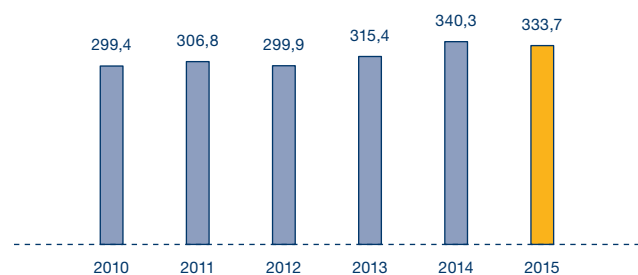
Nachdem im Sommer 2015 die Schuldenkrise in Griechenland vorerst durch ein weiteres Hilfspaket entspannt wurde, hat die politische Situation in zahlreichen Krisengebieten, wie beispielsweise in Syrien, der Türkei oder der Ukraine, negativ auf die gesamtwirtschaftliche Stimmung in Europa gewirkt. Die anhaltende Flüchtlingswelle sowie die Zunahme terroristischer Bedrohungen stellen viele europäische Staaten vor bisher ungekannte wirtschaftliche, politische und humanitäre Herausforderungen. Die Eurozone erreichte 2015 dennoch ein Wachstum von 1,5 %, für die Europäische Union insgesamt geht man im gleichen Zeitraum von einem leicht höheren Plus in Höhe von 1,9 % aus (Quelle: Europäische Kommission, November 2015 und OECD, Februar 2016). Getragen wurde das Wachstum durch starke Exporte, die dem vergleichsweise schwachen Euro geschuldet sind sowie dem niedrigen Ölpreis und den dadurch gestiegenen zur Verfügung stehenden Einkommen.

Die deutsche Wirtschaft wurde im Geschäftsjahr 2015 überwiegend durch die lebhaftere Binnennachfrage getragen. Vorteilhaft haben sich hierbei die günstige Arbeitsmarktlage sowie die zum Teil kräftigen Zuwächse der verfügbaren Einkommen ausgewirkt. Gemäß den Schätzungen der OECD vom Februar 2016 betrug das Wirtschaftswachstum in Deutschland im Jahr 2015 rund 1,4 %.

2015 WAR EIN SCHWIERIGES JAHR FÜR DEN HALBLEITER-MARKT

Im Geschäftsjahr 2015 lag das Marktvolumen des gesamten Halbleiter-Marktes bei 333,7 Mrd. USD nach 340,3 Mrd. USD im Vorjahr, dies bedeutet einen Rückgang um rund 1,9 % (Quelle: Gartner, Januar 2016) und damit den ersten Rückgang in der Halbleiter-Industrie seit 2012. Der starke US-Dollar sowie das allgemein abgeschwächte Wachstum bei Elektronikprodukten wie Smartphones, Tablets und PCs haben den Markt im abgelaufenen Geschäftsjahr belastet. Zudem sei die Nachfrage nach DRAM-Speichermedien rückläufig gewesen, schreibt Gartner.

Umsatzentwicklung im Halbleiter-Markt in Mrd. USD



Quelle: Gartner, 2011–2016

ENTWICKLUNG IM SEGMENT HALBLEITER-EQUIPMENT

Der Markt für Halbleiter-Equipment ist nach aktuellen Schätzungen des Branchenverbands Semi im Jahr 2015 um rund 0,6% geschrumpft. Die Gründe hierfür liegen – wie auch für die gesamte Halbleiter-Industrie – im Wesentlichen in den rückläufigen Wachstumsraten für Smartphones, Tablets und PCs. Der ansonsten branchentypische Anstieg der Verkaufszahlen vor der Urlaubssaison sei dieses Jahr ausgeblieben und führte am Ende zu einem schrumpfenden Gesamtmarkt.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden die Investitionen im Wesentlichen für Maschinen zur Bearbeitung von Wafergrößen von 300mm getätigt, nur rund 10% des Investments gingen in Maschinen für die Bearbeitung von 200mm Wafern oder noch kleineren Wafergrößen. Nach Aussage des Branchenverbands Semi wurde dabei überwiegend in Maschinen für die Herstellung von Speicherchips, insbesondere für DRAMs mit einer Strukturgröße von 21/20nm, investiert.

SÜSS MicroTec in Zahlen

ERTRAGSLAGE:

AUFTRAGSEINGANG, UMSATZ UND EBIT

Vergleich Gesamtjahreszahlen 2015 – Prognose 2015

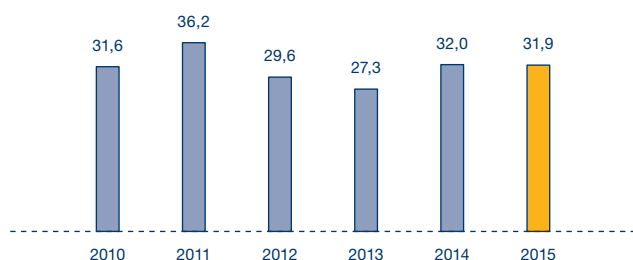
Im Prognosebericht des Lageberichts 2014 hat das Unternehmen für das Geschäftsjahr 2015 einen Umsatz von 130 bis 140 Mio. € sowie ein ausgeglichenes Ergebnis (EBIT) in Aussicht gestellt. Im August 2015 wurden die Umsatz- und Ergebnisprognosen für das laufende Geschäftsjahr angehoben. SÜSS MicroTec schloss das Geschäftsjahr 2015 mit einem Umsatz in Höhe von 148,5 Mio. € ab. Das EBIT erreichte einen Wert von 5,0 Mio. €. Damit lag das Unternehmen im Umsatz und Ergebnis leicht über der eigenen Erwartung.

	Prognose 2015	Angepasste Prognose 2015	Ergebnis 2015
Umsatz	130–140 Mio. €	135–145 Mio. €	148,5 Mio. €
EBIT	ausgeglichen	leicht positiv	5,0 Mio. €
EBIT-Marge	–	1%–2%	3,4%

Unternehmensentwicklung im Jahr 2015

Der Auftragseingang belief sich im Geschäftsjahr 2015 auf insgesamt 188,6 Mio. €, während im Vorjahr ein Auftragseingang von 134,3 Mio. € erzielt wurde. Insbesondere das vierte Quartal 2015, in dem ein Rekord-Auftragseingang von 79,7 Mio. € verbucht wurde, hatte großen Anteil daran. Damit lagen die Auftragseingänge 2015 rund 40,4% über den Auftragseingängen des Vorjahres. Zum 31. Dezember 2015 ergab sich ein Auftragsbestand von 117,6 Mio. €, der damit um rund 42,0 Mio. € über dem Auftragsbestand des Vorjahres (75,6 Mio. €) lag. Das Verhältnis von neu eingegangenen Aufträgen zu realisierten Umsätzen (Book-to-Bill-Ratio) lag bei 1,27 nach 0,92 im Vorjahr.

Umsatzentwicklung im Wafer Fab Equipment in Mrd. USD



Quelle: Gartner, 2011–2016

Die Ertragslage des SÜSS MicroTec-Konzerns zeigt im Geschäftsjahr 2015 einen Umsatzanstieg und ein positives Jahresergebnis. Die Umsatzerlöse erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 2,2 % und beliefen sich auf 148,5 Mio. €, während im Vorjahr Umsätze von 145,3 Mio. € erzielt wurden. Das EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) belief sich 2015 auf 5,0 Mio. €. 2014 wurde ein EBIT von 8,4 Mio. € erreicht.

Im umsatzstärksten Segment von SÜSS MicroTec, der Lithografie, wurde ein Umsatzplus von 9,6 Mio. € erzielt. Der Anteil der Umsätze des Segments Lithografie betrug 2015 knapp 72 % der gesamten Konzernumsätze. Im Segment Substrat Bonder war hingegen ein Umsatzrückgang um rund 11,0 Mio. € zu verzeichnen. Im Segment Fotomasken Equipment ergaben sich Umsatzzuwächse von 2,7 Mio. €, während im Segment Sonstiges ein Umsatzanstieg von 1,9 Mio. € verbucht werden konnte.

In den Umsatzkosten sind Abschreibungen auf aktivierte Entwicklungskosten in Höhe von 0,1 Mio. € enthalten. Die Neu-Aktivierungen beliefen sich auf 1 Tsd. €. Sowohl die Abschreibungen als auch die Neuaktivierungen auf Entwicklungskosten betreffen ausschließlich das Segment Lithografie. Im Vorjahr wurden Abschreibungen auf aktivierte Entwicklungskosten von 0,5 Mio. € erfasst. Die Neu-Aktivierungen summierten sich im Vorjahr auf 45 Tsd. €.

Im Geschäftsjahr 2015 wurde ein Rohertrag von 49,4 Mio. € erzielt, was einer Rohertragsmarge von 33,3 % entspricht. Im Vorjahr betrug der Rohertrag 48,8 Mio. €; die Rohertragsmarge 2014 belief sich auf 33,6 %.

Die Vertriebskosten des Geschäftsjahres haben sich erhöht und lagen bei 18,8 Mio. € (Vorjahr: 17,5 Mio. €), was – in Relation zum erzielten Umsatz – einer Aufwandsquote von 12,7 % (Vorjahr: 12,1 %) entspricht.

Die Verwaltungskosten reduzierten sich von 14,2 Mio. € im Vorjahr auf nun 13,3 Mio. € und entsprechen damit einer Aufwandsquote von 8,9 % (Vorjahr: 9,8 %). Im Vorjahr war in den Verwaltungskosten eine Abfindung für ein ausgeschiedenes Vorstandsmitglied enthalten, die sich auf 1,1 Mio. € belief.

Die Forschungs- und Entwicklungskosten erhöhten sich von 10,5 Mio. € im Vorjahr auf 12,8 Mio. €. Im Jahr 2015 hat SÜSS MicroTec – wie geplant – seine Aktivitäten im Bereich Forschung und Entwicklung deutlich ausgebaut und Mitarbeiter eingestellt.

Die sonstigen betrieblichen Erträge beliefen sich im Geschäftsjahr auf 4,9 Mio. € (Vorjahr: 4,5 Mio. €). Sie beinhalten – wie auch im Vorjahr – hohe Fremdwährungsgewinne, die sich aus der Umrechnung von Fremdwährungsposten in Euro ergeben

haben. Im Jahr 2015 konnten durch eine Stornovereinbarung mit einem Kunden Erträge von 0,6 Mio. € erzielt werden. Im Vorjahr wurden Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen von 1,3 Mio. € realisiert.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beliefen sich 2015 auf 4,4 Mio. € (Vorjahr: 2,7 Mio. €) und beinhalten vor allem Aufwendungen aus Fremdwährungsumrechnungen.

Das EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) belief sich im abgelaufenen Geschäftsjahr auf 5,0 Mio. €. 2014 wurde ein EBIT von 8,4 Mio. € erzielt.

Das Finanzergebnis belief sich 2015 auf -0,3 Mio. € (nach -0,2 Mio. € im Vorjahr).

Das Konzernergebnis vor Steuern von 4,7 Mio. € ist mit einem Steueraufwand von 4,5 Mio. € belegt, was einer durchschnittlichen Steueraufwandsquote von rund 95 % entspricht. Grund für den – in Relation zum Gewinn vor Steuern – außerordentlich hohen Steueraufwand sind vor allem im Geschäftsjahr 2015 aufgelaufene Verluste ausländischer Konzerngesellschaften (insbesondere in den USA), für die unter Berücksichtigung der aktuellen Konzernplanung (analog zu den Vorjahren) keine aktiven latenten Steuern angesetzt wurden. Dadurch wird für die in den ausländischen Gesellschaften entstandenen Verluste kein entsprechender Steuerertrag berücksichtigt.

Im Vorjahr war das Konzernergebnis vor Steuern von 8,2 Mio. € mit einem Steueraufwand von 3,6 Mio. € belegt, was einer durchschnittlichen Steueraufwandsquote von rund 44 % entspricht. Somit wick auch im Vorjahr die tatsächliche Steueraufwandsquote deutlich von der erwarteten Steueraufwandsquote ab. Grund für den – in Relation zum Gewinn vor Steuern – hohen Steueraufwand waren ebenfalls im Geschäftsjahr 2014 aufgelaufene Verluste ausländischer Konzerngesellschaften (insbesondere in den USA), für die keine aktiven latenten Steuern angesetzt wurden.

Im Konzern ergab sich ein Gewinn nach Steuern von 0,2 Mio. € (Vorjahr: 4,6 Mio. €). Das unverwässerte Ergebnis je Aktie betrug 0,01 € nach 0,24 € im Vorjahr.

Der Umsatz je Mitarbeiter reduzierte sich im Vergleich zum Vorjahr um 3,6 % von 221 Tsd. € auf 213 Tsd. € (basierend auf der jeweiligen Anzahl der Mitarbeiter zum Bilanzstichtag).

ENTWICKLUNG IN DEN EINZELNEN SEGMENTEN

Lithografie

Das Segment Lithografie umfasst die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb der Produktlinien Mask Aligner, UV-Projektionsscanner, Laser Processing Tools sowie Belacker und Entwickler. Die Fertigung dieser Produktlinien ist in Deutschland an den Standorten Garching bei München und seit Anfang 2010 in Sternenfels angesiedelt. Die Lithografiesparte wurde im ersten Quartal 2012 mit der Akquisition der Tamarack Scientific Co., Inc. (firmiert heute unter SUSS MicroTec Photonic Systems Inc.) verstärkt. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Corona, Südkalifornien, USA. Das Segment Lithografie ist mit einem Umsatzanteil von mehr als 70 % der größte Bereich der SUSS MicroTec-Gruppe. Die Komponenten, die auf diesen Maschinen gefertigt werden, gehen im Wesentlichen in die Endmärkte Advanced Packaging, Mikrosystemtechnik und Verbindungshalbleiter (LED) sowie 3D-Integration.

Im Geschäftsjahr 2015 erzielte das Segment Lithografie einen Auftragseingang von 149,6 Mio. € sowie einen Umsatz von 106,3 Mio. €. Dies entspricht einem Plus im Auftragseingang von 63,5 % sowie einem Plus im Umsatz von 9,9 % gegenüber dem Vorjahr. Der deutliche Anstieg im Auftragseingang wurde über alle Produktlinien erzielt. Bei den 300 mm Belackern und Entwicklern konnten Marktanteile zurückgewonnen und ausgebaut werden. Mit unseren neuartigen UV-Projektionsscannern ist es uns 2015 erstmals gelungen, einen Großauftrag für die Serienfertigung bei einem wichtigen Halbleiterhersteller zu gewinnen. Daneben war die Produktlinie Mask Aligner besonders bei MEMS-Kunden in Europa und den USA sehr erfolgreich.

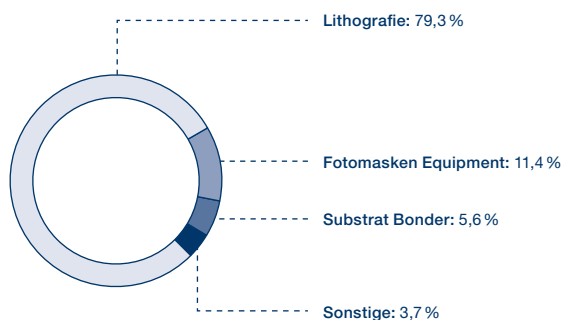
Der Rohertrag im Segment Lithografie lag im abgelaufenen Geschäftsjahr leicht unter dem Vorjahreswert. Die Rohertragsmarge lag 2015 bei 34,2 % nach 35,7 % im Vorjahr.

Das Segment Lithografie steuerte ein Segmentergebnis in Höhe von 9,7 Mio. € (Vorjahr: 10,7 Mio. €) zum Konzern-EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) bei. Damit ergibt sich für das Segment Lithografie eine Umsatzrendite von 9,1 %, die sich im Vergleich zum Vorjahr leicht verringert hat (Umsatzrendite des Vorjahres: 11,0 %). Wie bereits in früheren Berichten geschildert, hat sich die Wettbewerbssituation bei den Belackern und Entwicklern in den vergangenen Jahren deutlich verstärkt und zu einer spürbaren Verringerung der erzielbaren Margen geführt. Die Margen in der Produktlinie Mask Aligner blieben dagegen stabil.

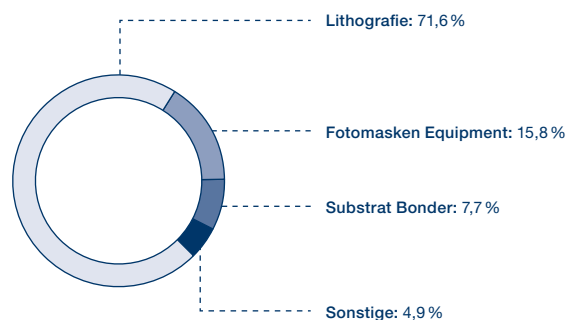
Kennzahlen Lithografie

in Mio. €	2015	2014
Auftragseingang	149,6	91,5
Segmentumsatz	106,3	96,7
Segmentergebnis EBIT	9,7	10,7
Nettovermögen	51,3	50,3

Auftragseingang nach Segmenten



Umsatz nach Segmenten



Substrat Bonder

Das Segment Substrat Bonder umfasst die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb der Substrat (Wafer) Bonder. Die Fertigung ist an unserem größten Standort in Sternenfels angesiedelt. Zu den adressierten Märkten der Substrat Bonder zählen die Mikrosystemtechnik, die Verbindungshalbleiter sowie die 3D-Integration.

Das Segment Substrat Bonder entwickelte sich sowohl im Auftragseingang mit 10,5 Mio. € (Vorjahr: 17,2 Mio. €) als auch im Umsatz mit 11,4 Mio. € (Vorjahr: 22,4 Mio. €) erneut rückläufig. Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden gegenüber 2014 deutlich weniger Aufträge erzielt, der Hauptgrund hierfür liegt in der Refokussierung der Produktlinie permanente Bonder. Wurden in diesem Bereich 2014 noch Aufträge für permanente Produktionsbonder im einstelligen Millionen-Euro-Bereich verbucht, so lag der Anteil am Auftragseingang im Jahr 2015 nahezu bei null. Eine ähnliche Situation ergibt die Analyse der Umsatzentwicklung: Auch hier wurden 2015 deutlich weniger Umsätze mit permanenten Produktionsbondern als noch im Vorjahr realisiert. Für die Zukunft erwarten wir in diesem Bereich wieder deutlich steigende Auftragseingänge und Umsätze, insbesondere durch die Einführung neuer Produkte sowie die Rückgewinnung von Marktanteilen bei der MEMS- und LED-Herstellung.

Das Rohergebnis des Segments Substrat Bonder war im abgelaufenen Geschäftsjahr positiv. Die Rohertragsmarge verbesserte sich erneut von 13,9% auf 19,3%. Die seit dem Geschäftsjahr 2014 erzielten Margen im Bereich Temporary Bonding und Debonding sowie das verbleibende Geschäft mit permanenten Bond-Systemen haben sich nachhaltig verbessert, sind jedoch aufgrund der insgesamt niedrigen Stückzahlen weiterhin unterdurchschnittlich. Im Segment Substrat Bonder ergibt sich ein Segmentergebnis (EBIT) von -4,0 Mio. € nach -2,4 Mio. € im Vorjahr.

Kennzahlen Substrat Bonder

in Mio. €	2015	2014
Auftragseingang	10,5	17,2
Segmentumsatz	11,4	22,4
Segmentergebnis EBIT	-4,0	-2,4
Nettovermögen	5,7	7,8

Fotomasken Equipment

Das Segment Fotomasken Equipment umfasst die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von Maschinen, die auf die Reinigung und Prozessierung von Fotomasken für die Halbleiter-Industrie spezialisiert sind, und ist am Standort Sternenfels bei Stuttgart angesiedelt. Zu den adressierten Märkten des Segments Fotomasken Equipment zählt die Halbleiter-Industrie, hier ist SÜSS MicroTec überwiegend im Frontend tätig.

Das Segment Fotomasken Equipment entwickelte sich im abgelaufenen Geschäftsjahr sowohl im Auftragseingang als auch im Umsatz besser als im Vorjahr. Der Auftragseingang lag Ende Dezember 2015 bei 21,5 Mio. € (Vorjahr: 20,2 Mio. €). Der Segmentumsatz belief sich auf 23,5 Mio. € nach 20,8 Mio. € im Jahr 2014.

Aufgrund einiger margenstarker Aufträge lag die Rohertragsmarge im Geschäftsjahr 2014 bei 40,3%. Im Geschäftsjahr 2015 konnte ein Wert von 31,5% erreicht werden.

Das Segment Fotomasken Equipment trug mit einem Segmentergebnis von 2,3 Mio. € (Vorjahr: 4,7 Mio. €) zum Konzern-EBIT bei. Die Umsatzrendite lag bei 9,9% und hat sich damit im Vergleich zum sehr starken Vorjahr (Umsatzrendite 2014: 22,7%) deutlich verringert. Die Gründe für die außergewöhnlich hohe Umsatzrendite 2014 waren im Wesentlichen einige margenstarke Aufträge.

Kennzahlen Fotomasken Equipment

in Mio. €	2015	2014
Auftragseingang	21,5	20,2
Segmentumsatz	23,5	20,8
Segmentergebnis EBIT	2,3	4,7
Nettovermögen	6,8	3,7

Sonstige

Das Segment Sonstige umfasst die Mikrooptik-Aktivitäten am Standort Hauterive, Schweiz, sowie die größtenteils auf Segmentebene nicht zurechenbaren Kosten der zentralen Konzernfunktionen.

Der Auftragseingang steigerte sich deutlich von 5,4 Mio. € im Geschäftsjahr 2014 auf 7,0 Mio. € im Jahr 2015. Der Segmentumsatz belief sich auf 7,3 Mio. € nach 5,4 Mio. € im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Größten Anteil am Umsatz und Auftragseingang hatte dabei – wie auch im Vorjahr – das Geschäftsfeld Mikrooptik, das einen erhöhten Auftragseingang von 6,6 Mio. € (Vorjahr: 5,1 Mio. €) sowie im Umsatz einen Anstieg von 5,1 Mio. € auf 6,8 Mio. € erzielte.

Kennzahlen Sonstige

in Mio. €	2015	2014
Auftragseingang	7,0	5,4
Segmentumsatz	7,3	5,4
Segmentergebnis EBIT	-3,1	-4,5
Nettovermögen	19,9	19,3

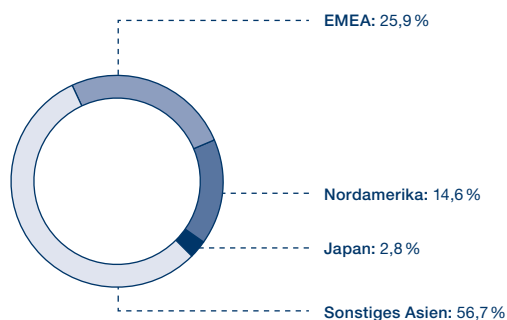
ENTWICKLUNG IN DEN WICHTIGSTEN REGIONEN

Europa, Nordamerika und Asien sind die für das Geschäft von SÜSS MicroTec wichtigen Weltregionen. Dabei unterteilen wir Asien jedoch in Japan und „Sonstiges Asien“, um dem Umstand Rechnung zu tragen, dass unsere Kunden im Markt Advanced Packaging vornehmlich außerhalb Japans – insbesondere in Taiwan – ansässig sind. Dieser Markt ist allerdings auch schwankungsanfälliger als jener für Verbindungshalbleiter und MEMS.

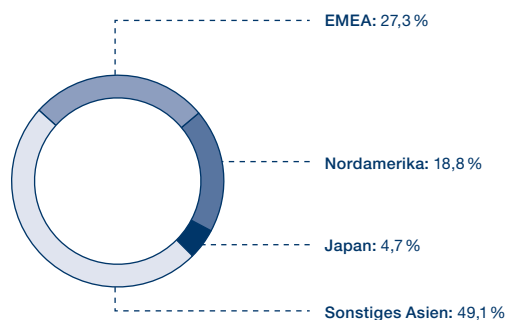
In allen Regionen bis auf Japan konnten im vergangenen Geschäftsjahr deutliche Zuwächse im Auftragseingang erwirtschaftet werden. Nordamerika steigerte seinen Auftragseingang von 21,9 Mio. € im Jahr 2014 auf 27,6 Mio. € im Geschäftsjahr 2015. Dieser Zuwachs um 26,0% entstammt im Wesentlichen der guten Positionierung bei führenden MEMS-Kunden in den USA. In der wichtigsten Region „Sonstiges Asien“ (ohne Japan) verzeichnete die SÜSS MicroTec-Gruppe ein enormes Auftragsplus in Höhe von 70,7% auf 107,0 Mio. € (Vorjahr: 62,7 Mio. €). Die Gründe hierfür liegen in einem generellen Anstieg der Nachfrage nach unseren Lithografieprodukten, insbesondere aus der Region Taiwan sowie der Region Asien and Pazifik. Dazu gehören unter anderem die 300 mm Belacker- und Entwickler-Systeme sowie UV-Projektionsscanner. Auch Europe Middle East and Africa (EMEA) konnte gegenüber Vorjahr deutlich zulegen und erreichte einen Auftragseingang von 48,8 Mio. €, ein zweistelliges Plus gegenüber Vorjahr von 19,0%. Lediglich Japan verringerte seinen Auftragseingang im Vergleich zum Vorjahr um 40,2% und erreichte damit einen Auftragseingang von lediglich 5,2 Mio. €.

Beim Umsatz zeigt sich regional ein sehr unterschiedliches Bild. Während in Nordamerika deutliche Zuwächse verbucht werden konnten, haben die Regionen EMEA und Japan gegenüber Vorjahr geringere Umsätze erwirtschaftet. EMEA verzeichnete einen Rückgang um 5,2% auf 40,5 Mio. € während der Rückgang in Japan mit -30,7% deutlicher ausfiel. Nordamerika konnte durch die erhöhte Umsatzlegung im Bereich Fotomaschinen Equipment einen Umsatzzuwachs um 30,2% auf 28,0 Mio. € erreichen. Die größte Region – „Sonstiges Asien“ – verbuchte ein leichtes Umsatzplus von 2,9% auf 73,0 Mio. €.

Auftragseingang nach Regionen



Umsatz nach Regionen



FINANZ- UND VERMÖGENSLAGE

Eine stabile Finanz- und Vermögenslage zeichnet SÜSS MicroTec aus

Die Net Cash-Position des Konzerns – der Saldo aus flüssigen Mitteln sowie verzinslichen Wertpapieren und Finanzverbindlichkeiten – erhöhte sich von 38,0 Mio. € im Vorjahr auf 40,0 Mio. € zum 31. Dezember 2015. Der Bestand an liquiden Mitteln und verzinslichen Wertpapieren erhöhte sich von 48,3 Mio. € im Vorjahr auf 49,1 Mio. € zum Ende des Berichtsjahres.

Der Cashflow aus dem operativen Geschäft belief sich auf 4,7 Mio. € (Vorjahr: 5,1 Mio. €). Zum 31. Dezember 2015 wies SÜSS MicroTec hohe Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen aus, die sich mit rund 4,7 Mio. € positiv auf den operativen Cashflow auswirkten. Auch die hohen Steuerverbindlichkeiten in Deutschland sowie der konzernweit geringe Bestand an Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wirkten mit insgesamt 5,0 Mio. € liquiditätserhöhend. Dagegen machte sich der zum Jahresende hohe Bestand an Vorräten mit 8,1 Mio. € liquiditätsmindernd bemerkbar. Der Anstieg des Vorratsvermögens im Vergleich zum Vorjahr entfiel vor allem auf verstärkte Zukäufe von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen, die dem am Jahresende hohen Auftragsbestand geschuldet sind.

Der Cashflow aus der Investitionstätigkeit betrug ohne Berücksichtigung der Investitionen in Wertpapiere -3,4 Mio. € (Vorjahr: -3,0 Mio. €). Die Investitionen in Sachanlagen betrafen teilweise weitere Einbauten in die gemieteten Räume der SÜSS MicroOptics (Hauterive, Schweiz), für die Mittelabflüsse von rund 0,5 Mio. € zu verzeichnen waren. In den Gebäuden an den Produktionsstandorten Garching und Sternenfels wurden Erneuerungen und Einbauten vorgenommen. Darüber hinaus wurden vor allem Neuanschaffungen in technische Anlagen und Maschinen sowie in Betriebs- und Geschäftsausstattung der deutschen Gesellschaften getätigt. Die Investitionen in immaterielle

Vermögenswerte betrafen vorwiegend Erweiterungen des konzernweiten SAP-Systems, an das nun auch die SÜSS MicroTec Photonic Systems Inc. (Corona, USA) angeschlossen ist, sowie die Einführung einer neuen CAD-Software.

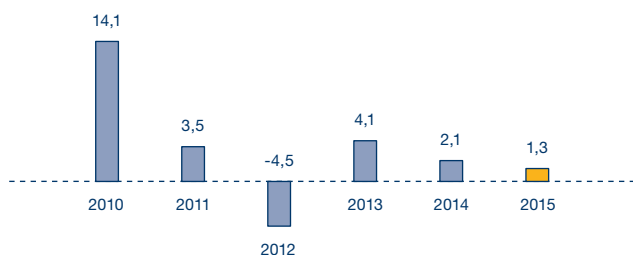
Der freie Cashflow belief sich damit – vor Berücksichtigung von Wertpapiererwerben und -verkäufen – auf 1,3 Mio. €. Im Vorjahr wurde ein freier Cashflow (bereinigt um die Effekte aus Wertpapiererwerben und -verkäufen) von 2,1 Mio. € erzielt.

Der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit belief sich auf -1,2 Mio. € (Vorjahr: -1,2 Mio. €) und resultiert aus den geleisteten Tilgungen für die beiden Bankdarlehen der SÜSS MicroTec AG, die der Finanzierung der beiden Betriebsgrundstücke Garching und Sternenfels dienen.

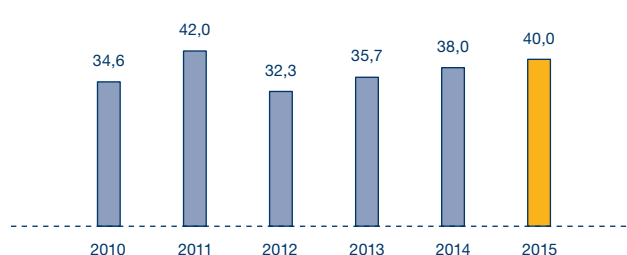
Neben liquiden Mitteln und verzinslichen Wertpapieren in Höhe von 49,1 Mio. € (Vorjahr: 48,3 Mio. €) verfügt der Konzern zum Ende des Berichtsjahres über inländische Aval- und Kreditlinien von 9,0 Mio. € (Vorjahr: 8,0 Mio. €). Die Linie wurde im Berichtsjahr ausschließlich in Form von Avalen in Anspruch genommen. Der wesentliche Teil davon entfällt auf Anzahlungsbürgschaften. Zum Bilanzstichtag betrug die Inanspruchnahme 5,4 Mio. €.

Ein Bankenkonsortium unter Führung der Deutsche Bank AG und unter Beteiligung der DZ Bank AG und der Baden-Württembergischen Bank stellt Kredit- und Avallinien in Höhe von 4,5 Mio. €. Diese Linien wurden bis auf weiteres gewährt und wurden ohne Covenants gestellt. Die Deutsche Bank gewährte darüber hinaus eine bis zum 30. April 2016 befristete Avallinie in Höhe von 1,0 Mio. €. Die Linien können von der SÜSS MicroTec AG oder der SÜSS MicroTec Lithography GmbH in Anspruch genommen werden.

Free Cashflow in Mio. €



Nettoliiquidität in Mio. €



Zwischen der SUSS MicroTec Photomask Equipment GmbH & Co. KG und der Baden-Württembergischen Bank Mannheim besteht ein Rahmenkreditvertrag, mit dem eine Kreditlinie in Höhe von 1,0 Mio. € gestellt wird. Die Kreditlinie läuft auf unbestimmte Zeit und wurde ohne Covenants gestellt.

Bei einer Versicherungsgesellschaft besteht im Zusammenhang mit einem Kautionsversicherungsvertrag ein Bürgschaftsrahmen in Höhe von 2,5 Mio. €. Der Kautionsversicherungsvertrag läuft bis auf weiteres. Zur Sicherung dieser Linie wurde ein Festgeldkonto in Höhe von 0,3 Mio. € an die Versicherungsgesellschaft abgetreten.

Der Konzern verfügt insgesamt über genügend finanziellen Spielraum, notwendige Produktentwicklungen oder andere strategische Aktivitäten zu finanzieren.

Neben dem Geschäfts- oder Firmenwert bestimmen im Wesentlichen die durch Unternehmensakquisition erworbene Technologie der SUSS MicroTec Photonic Systems sowie die Betriebsgrundstücke in Garching und in Sternenfels die langfristigen Vermögenswerte.

Der Geschäfts- oder Firmenwert beträgt 15,8 Mio. € (Vorjahr: 15,5 Mio. €). Ein Teil des Goodwills (2,4 Mio. USD) wird in US-Dollar geführt und unterliegt daher Währungsschwankungen. Der gesamte Geschäfts- oder Firmenwert ist dem Segment Lithografie zugeordnet.

Die aktivierten Entwicklungskosten weisen zum 31. Dezember 2015 einen Buchwert von 0,3 Mio. € (Vorjahr: 0,4 Mio. €) auf, der komplett dem Segment Lithografie zuzuordnen ist. Sie spielen für die Vermögenslage des Konzerns nur noch eine untergeordnete Rolle.

Darüber hinaus enthalten die langfristigen Vermögenswerte Lizenzen und Patente sowie das bei der SÜSS MicroTec AG aktivierte SAP-System, deren Buchwerte sich auf 2,8 Mio. € (Vorjahr: 2,7 Mio. €) summieren. Sie entfallen in Höhe von 1,5 Mio. € (Vorjahr: 1,5 Mio. €) auf die Segmente Lithografie, Substrat Bonder und Fotomasken Equipment sowie in Höhe von 1,3 Mio. € (Vorjahr: 1,2 Mio. €) auf das Segment Sonstige. Unter den immateriellen Vermögenswerten ist außerdem die im Rahmen der Photonic Systems-Akquisition erworbene Technologie ausgewiesen, die zum Stichtag einen Restbuchwert von 1,2 Mio. € (Vorjahr: 1,4 Mio. €) aufwies und dem Segment Lithografie zugeordnet ist. Die Technologie dotiert in US-Dollar und wird planmäßig über acht Jahre abgeschrieben.

Größten Anteil am konzernweiten Sachanlagevermögen haben die beiden Betriebsgrundstücke in Garching und Sternenfels, die zum Jahresende einen Restbuchwert von 13,8 Mio. € (Vorjahr: 13,7 Mio. €) aufwiesen. Dort sind die SUSS MicroTec Lithography GmbH, die SUSS MicroTec Photomask Equipment GmbH & Co. KG sowie die SÜSS MicroTec AG ansässig.

Das übrige Sachanlagevermögen ist von geringerer Bedeutung für die Vermögenslage des Konzerns, da die Gruppe auf kostenintensive Produktionsanlagen in der Regel nicht angewiesen ist. Die Investitionen beliefen sich (ohne Grund und Boden bzw. Gebäude) im Berichtsjahr auf 2,1 Mio. € im Vergleich zu 1,3 Mio. € im Vorjahr.

Der Buchwert des Sachanlagevermögens hat sich im Vergleich zum Vorjahr nur unwesentlich verändert.

Die latenten Steueransprüche betragen zum Stichtag 2,5 Mio. € nach 3,9 Mio. € im Vorjahr. Sie reduzierten sich im Wesentlichen durch die Nutzung von aktiven latenten Steuern auf Verlustvorträge. Die ertragsteuerliche Organschaft in Deutschland (mit der SÜSS MicroTec AG als Organträger und den Organgesellschaften SUSS MicroTec Lithography GmbH und SUSS MicroTec REMAN GmbH) hat 2015 ein deutlich positives Ergebnis erzielt und nutzt damit einen Teil der im Vorjahr entstandenen Verlustvorträge. Es ist davon auszugehen, dass die deutschen Gesellschaften die noch verbleibenden Verlustvorträge im kommenden Jahr 2016 vollständig nutzen werden. Für die Verlustvorträge der US-Gesellschaften wurden hingegen – unter Berücksichtigung der aktuellen Konzernplanung – keine aktiven latenten Steuern auf Verlustvorträge angesetzt.

Die kurzfristigen Vermögenswerte sind im Berichtsjahr um 10,6 Mio. € auf 133,8 Mio. € angestiegen. Der Anstieg ist hauptsächlich auf den stark gestiegenen Bestand an Vorratsvermögen zurückzuführen. Um dem hohen Auftragsbestand Rechnung zu tragen, haben alle produzierenden Gesellschaften des Konzerns zum Jahresende verstärkt Materialien eingekauft.

Die Vorräte erhöhten sich von 58,9 Mio. € zum Vorjahresstichtag auf 68,7 Mio. € zum Jahresende. Der Anstieg ist im Wesentlichen auf den deutlich höheren Bestand an Materialien und Hilfsstoffen zurückzuführen, bei denen ein Zuwachs um 6,5 Mio. € auf 28,6 Mio. € zu verzeichnen war. Auch der Bestand an unfertigen Erzeugnissen und Fertigerzeugnissen erhöhte sich um 1,4 Mio. € bzw. 1,9 Mio. €, während sich der Bruttobestand an Demonstrationsgeräten um rund 0,5 Mio. € reduzierte.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen reduzierten sich im Vergleich zum Vorjahr von 13,4 Mio. € auf 13,1 Mio. €. Der Rückgang ist im Wesentlichen stichtagsbedingt.

Der SÜSS MicroTec Konzern wies zum 31. Dezember 2015 keine Wertpapiere aus. Im Vorjahr belief sich der Bestand an Wertpapieren noch auf 1,0 Mio. €. Der Bestand an liquiden Mitteln erhöhte sich von 47,3 Mio. € auf 49,1 Mio. €.

Der Anstieg der sonstigen Vermögenswerte von 1,7 Mio. € im Vorjahr auf 2,3 Mio. € zum Jahresende ist im Wesentlichen auf höhere Umsatzsteuerforderungen zurückzuführen, die sich stichtagsbedingt ergeben haben.

Die langfristigen Schulden reduzierten sich von 13,9 Mio. € auf 13,1 Mio. €. Größten Anteil an den langfristigen Schulden haben die Finanzverbindlichkeiten, die sich im Geschäftsjahr auf 7,9 Mio. € (Vorjahr: 9,1 Mio. €) beliefen. Neben dem langfristigen Teil des Darlehens Sternenfels wird hier auch der langfristige Teil des Darlehens ausgewiesen, das der Grundstücksfinanzierung Garching dient. Unter den langfristigen Schulden werden zudem die Pensionsverpflichtungen des SÜSS MicroTec-Konzerns ausgewiesen, für die zum Jahresende ein Betrag von 5,1 Mio. € (Vorjahr: 4,8 Mio. €) passiviert war.

Bei den kurzfristigen Schulden war ein deutlicher Anstieg von 38,0 Mio. € im Vorjahr auf 45,4 Mio. € zum Bilanzstichtag zu verzeichnen. Größten Anteil an diesem Anstieg hatte der Stand der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, die sich zum Jahresende auf 8,5 Mio. € (Vorjahr: 3,4 Mio. €) beliefen. Der Anstieg ist im Wesentlichen stichtagsbedingt. Darüber hinaus sind auch die Steuerschulden von 1,5 Mio. € im Vorjahr auf 3,3 Mio. € zum Jahresende angestiegen. Die sonstigen Verbindlichkeiten haben sich von 22,8 Mio. € im Vorjahr auf 23,5 Mio. € erhöht. Neben abgegrenzten Personalkosten sind in dem Betrag auch die erhaltenen Kundenanzahlungen enthalten, die sich zum Geschäftsjahresende auf 18,2 Mio. € (Vorjahr: 18,0 Mio. €) beliefen.

Das Eigenkapital des SÜSS MicroTec-Konzerns hat sich seit dem 31. Dezember 2014 um 2,7 Mio. € auf 118,7 Mio. € erhöht. Die Eigenkapitalquote sank aufgrund der erhöhten Bilanzsumme im Jahresvergleich von 69,1 % auf 67,0 %.

INVESTITIONEN

Gezielte Investitionen stärken das Unternehmen

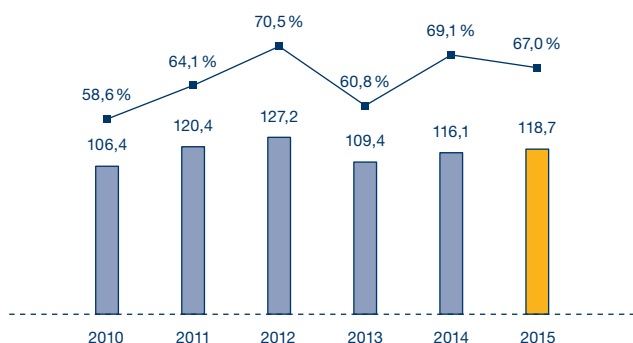
Die SÜSS MicroTec AG ist Eigentümerin der Betriebsgrundstücke in Garching und Sternenfels, an denen der Firmensitz sowie die Betriebe der SÜSS MicroTec Lithography GmbH und der SÜSS MicroTec Photomask Equipment GmbH & Co. KG ihren Sitz haben. Die SÜSS MicroTec AG investiert laufend in die Betriebsgebäude an den beiden Standorten, um die Lagerräume sowie die Produktions- und Verwaltungsräume auf dem neuesten technischen Stand zu halten.

Bedingt durch die Struktur des Unternehmens sind Investitionen in technische Anlagen und Maschinen keine wesentliche Komponente in der Unternehmensentwicklung. Die wesentliche Wertschöpfung entsteht durch Design, Montage und Justage der Komponenten sowie der entsprechenden Softwaresteuerung. Für diese Tätigkeiten sind keine besonderen Anlagen und Maschinen erforderlich.

Wir gehen davon aus, dass sich die Investitionen in Sachanlagen langfristig in einem Bereich von ca. 1 bis 2 % des Umsatzes bewegen werden. Eine Ausnahme stellt nur die in dem Segment Sonstige enthaltene Produktlinie Mikrooptik dar. In dieser Produktlinie wird Kleinserienfertigung betrieben, für die entsprechende Fertigungsmaschinen notwendig sind.

Für Entwicklungsleistungen, die nach IFRS die Voraussetzungen zur Aktivierung erfüllen, werden immaterielle Vermögenswerte erfasst. Ein Teil der Investitionen ist daher dem Bereich immaterielle Vermögenswerte zuzuordnen.

Eigenkapital in Mio. € und **Eigenkapitalquote**



Die SÜSS MicroTec AG ist Eigentümerin des konzernweiten SAP-Systems, das sowohl von den deutschen Gesellschaften als auch von der SUSS MicroTec, Inc. (Corona, USA) und von der SUSS MicroTec (Taiwan) Company Ltd. (Hsinchu, Taiwan) genutzt wird. 2015 wurde die SUSS MicroTec Photonic Systems (Corona, USA) erfolgreich an das konzernweite SAP-System angeschlossen.

FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG

Die Forschungs- und Entwicklungsausgaben erhöhten sich von 10,5 Mio. € im Vorjahr auf 12,8 Mio. €, was im Geschäftsjahr 2015 in Relation zum Umsatz einer Aufwandsquote von 8,6 % (Vorjahr: 7,2 %) entspricht. Sie betrafen mit 8,0 Mio. € (Vorjahr: 6,9 Mio. €) das Segment Lithografie und mit 2,2 Mio. € (Vorjahr: 1,5 Mio. €) das Segment Substrat Bonder. 1,9 Mio. € (Vorjahr: 1,6 Mio. €) waren dem Segment Fotomaschinen Equipment zuzuordnen.

Ende 2015 waren 147 Mitarbeiter – und damit fast jeder fünfte Mitarbeiter von SÜSS MicroTec – im Bereich Forschung und Entwicklung tätig (Vorjahr: 128 Mitarbeiter).

Lithografie

Das größte Segment vereinigt die Produktlinien Exposure (Mask Aligner, UV-Projektionsgeräte), Laser Processing sowie Belacker und Entwickler.

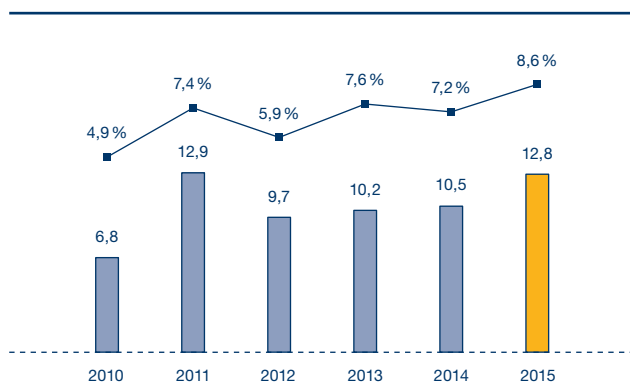
Die Belacker- und Entwickler-Produktgruppe fokussierte ihre Forschungs- und Entwicklungsarbeiten im Jahr 2015 auf drei wesentliche Schwerpunkte. Zunächst wurden sowohl für die automatisierte 200mm, als auch die 300mm Geräteplattform gezielte Verbesserungen der vorhandenen Basis-Systeme entwickelt. So wurde in der 200mm Anlage beispielsweise die Luftströmung in den Belackermodulen optimiert, was einerseits zu verbesserten Prozessergebnissen, andererseits zu reduzierten

Betriebskosten aufgrund niedrigerer Anforderungen an die Abluftanlage beim Kunden führt. Die Implementierung eines neuen Handhabungs-Systems in der ACS300 Gen2 verbessert den Durchsatz der Anlage und führt somit ebenfalls zu optimierten Betriebskosten der Anlage. Auch die Servicefreundlichkeit wurde durch Detailverbesserungen optimiert und bringt beide Plattformen auf höchsten Standard.

Daneben wurde ein von Grund auf neues Dispens-System für Chemikalien entwickelt. Bisher mussten sich Kunden für komplexe und somit kostenintensive Pumpenlösungen für höchste Dosier- und Wiederholgenauigkeiten oder einfach aufgebaute druckbasierte Systeme entscheiden. Auf Basis eines druckbasierten Systems wurden Kontroll- und Messmöglichkeiten an prozessrelevanten Stellen hinzugefügt. In Kombination mit intelligenten Kontrollalgorithmen konnte so ein System mit der Einfachheit eines druckbasierten Dispens-Systems bei gleichzeitiger Dosier- und Wiederholgenauigkeit eines Pumpen-Systems geschaffen werden.

Als weiteres Schwerpunktthema wurde die Software der Produktionsanlagen optimiert und erweitert. Eine Kernkomponente und stark durchsatzbestimmend ist der sogenannte Scheduling Algorithmus. Dieser plant alle Transporte der Substrate in der Anlage zu und von den verschiedenen Prozessmodulen und stellt sicher, dass diese optimal ausgelastet sind. Durch intensive Untersuchungen und Arbeiten konnte eine neue Softwarekomponente entwickelt werden, die der Forderung nach höchstmöglichem Durchsatz bei gleichzeitiger Prozessflexibilität gerecht wird. Die Entwicklungsarbeiten stellen ebenfalls sicher, dass das bereits erwähnte neue Handhabungs-System der ACS300 Gen2 optimal genutzt wird.

Forschungs- und Entwicklungsaufwand (F+E) in Mio. € und F+E Quote in % vom Umsatz



Bereits im Geschäftsjahr 2014 hat die Produktlinie Mask Aligner mit der MA200 Gen3 eine neue Maschinengeneration des Vollautomaten auf den Markt gebracht. Ziel ist es, den Kunden eine stetige Verbesserung der Cost-of-Ownership bieten zu können. Im Verlauf des Geschäftsjahres 2015 konnte der Durchsatz erneut deutlich erhöht werden. Im Rahmen der permanenten Produktweiterentwicklung wurden die Prozesse für die Hochvolumenproduktion stabilisiert. Neue Digitalkameras und verbesserte Mikroskope ermöglichen eine deutlich höhere Auflösung und bessere Bildqualität für die Justiermarkenerkennung. So können Maske und Wafer nun noch genauer zueinander ausgerichtet werden. Dieser für den Kunden bedeutsame Qualitätsparameter „Overlay“ ist besonders für die Herstellung von komplexen Strukturen mit vielen Belichtungsschritten entscheidend. Zudem sind die Kameras deutlich empfindlicher, so dass selbst schlecht sichtbare Strukturen/Marken auch ohne den Einsatz von Spezialausrüstungen möglich sind.

Im Bereich der 200mm Wafer Bearbeitung besteht weiterhin ein reges Interesse an der Handhabung von stark gebogenen Wafern, welches insbesondere durch die MA200 Gen3 abgedeckt wird. Bei 300mm Wafern ist die Handhabung von stark gebogenen besonders bei der Herstellung von Bildsensoren wichtig. Durch umfangreiche Weiterentwicklungen an der MA300 und ihren Spezialwerkzeugen sowie der Softwareprozesse können nun auch hier stark gebogene Wafer zuverlässig verarbeitet werden.

Kameras, die auf Wafer-Ebene hergestellt wurden, finden sich heute in nahezu allen Mobiltelefonen und anderen mobilen Geräten wie Touchpads und Laptops. Diese Kameras bestehen aus zwei Hauptkomponenten: dem CMOS-Bildsensor und der sogenannten Optik auf Wafer-Ebene (Wafer-Level Optics – WLO). Einen wichtigen Bestandteil der Optiken stellen kleine Linsen dar. Dieser technologisch anspruchsvolle Spezialbereich hat ein großes Marktpotenzial für SÜSS MicroTec. In Zusammenarbeit mit Leitkunden wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr neuartige Prozesse und Spezialwerkzeuge für die MA/BA8 Gen3 entwickelt. Ziel ist es, die nächste Generation von Wafer-Level Optics-Technologien zu entwickeln, die die kundenspezifische Integration von optischen Bauelementen in Halbleiterprozesse ermöglicht.

Die SELECT-Funktionalität zur selektiven Plasmabehandlung wird insbesondere zur Vorbereitung der Wafer zum Bonden verwendet. Diese innovative Funktionalität für die MA/BA8 Gen3, Mask- und Bond Aligner ist nun auch für Wafer mit einem Durchmesser bis 200mm verfügbar.

Im Geschäftsjahr 2015 hat sich die wesentliche Entwicklungsarbeit am Standort Corona auf die Weiterentwicklung der UV-Projektionsscannertechnologie fokussiert. So konnten beim Projektionsscanner DSC300 Gen2 deutliche Durchsatzsteigerungen von bis zu 50% erreicht werden. Damit können wir unseren Kunden zukünftig eine deutlich verbesserte Cost-of-Ownership bieten. Im Jahresverlauf wurden bei der DSC300 Gen2 zudem erweiterte Automatisierungsfunktionen, wie beispielsweise ein automatischer Blendenwechsler zur Optimierung der Optik, entwickelt und in die Maschine integriert. Darüber hinaus lag der wesentliche Fokus der Produktlinie auf der Prozessqualifizierung und Optimierung des Gerätes im Hinblick auf die Wachstumsfelder Copper-pillar bumping und Fan-out Wafer-Level Packaging. Dank der umfassenden Weiterentwicklung der DSC300 Gen2 sowie der Verbesserung verschiedener Prozessabläufe ist es uns gelungen, einen ersten großen Kunden zu gewinnen, der die Scannertechnologie in der Volumenfertigung einsetzen wird.

Substrat Bonder

Das Segment untergliedert sich in die beiden Teilbereiche temporäres und permanentes Bonden.

Im Bereich permanentes Bonden wurde im Geschäftsjahr 2015 ein neuer halbautomatischer Wafer Bonder entwickelt und in den Markt eingeführt. Das halbautomatische System XB8 kann Wafergrößen bis 200mm sowie verschiedene Substratgrößen und -typen bearbeiten und basiert auf der Steuerungsplattform des im Jahr 2014 entwickelten SB6/8 Gen2 Wafer Bonders. Im Gegensatz zu den bis zu 20kN Bondkraft, welche der SB6/8 Gen2 bietet, kann der neue XB8 Bonder bis zu 60kN beziehungsweise 100kN Bondkraft bei Verwendung von 200mm Wafern aufbringen. Derart hohe Bondkräfte sind sowohl für aktuelle Thermokompressionsbondprozesse, beispielsweise Kupfer-zu-Kupfer-Bondverbindungen wie sie für Anwendungen in MEMS und der 3D-Integration eingesetzt werden, aber auch für andere metallische Bondprozesse notwendig, bei denen die Anzahl der Sensoren je Wafer und damit auch der Anteil der zu verbindenden Metallflächen zunimmt. Neben der Möglichkeit sehr hohe Bondkräfte aufzubringen verfügt der XB8 Wafer Bonder über ein doppelseitiges, symmetrisch aufgebautes keramisches Heizer-System mit aktiver Kühlung, welches für Temperaturen von bis zu 550°C ausgelegt ist und damit die Anforderungen heutiger und zukünftiger Prozessanforderungen aus den Bereichen MEMS, LED und der 3D-Integration abdeckt.

Im Bereich temporäres Bonden konnte die Marktposition im Bereich der TSV-basierten 3D-Speicherchips weiter gefestigt werden, in dem wir einen zweiten asiatischen Produktionskunden für einen Teil unserer Gerätelösung gewinnen konnten. Die für diesen Kunden entwickelten Detailverbesserungen an einzelnen Prozessmodulen wurden nach der Kundenqualifikation

in die Serie übernommen. Darüber hinaus wurden Entwicklungsprojekte für eine optimierte Sequenzsteuerung am temporären Bonder, welche zur Verbesserung der Bedienerfreundlichkeit, der Stabilität und des Durchsatzes führt, sowie Hardwareverbesserungen zur Erhöhung der Prozessflexibilität und einer erweiterten Parameterüberwachung am Debonder in enger Abstimmung mit dem bestehenden asiatischen Schlüsselkunden durchgeführt. Die daraus resultierenden Verbesserungen wurden auf den bei einem Kunden bereits in den Vorjahren installierten Geräten zur 3D-Speicherchip-Herstellung nachgerüstet und qualifiziert.

Der Fokus auf der Applikationsseite lag im abgelaufenen Geschäftsjahr neben den Entwicklungspartnerschaften mit externen Forschungsinstituten wie dem imec, bei denen neuartige Prozesse und Material-Systeme auf unseren temporären Bondern qualifiziert werden, auf der direkten Kooperation mit Materialherstellern, um Prozessabläufe effizienter und damit kostengünstiger zu gestalten. In Zusammenarbeit mit einem asiatischen Materialhersteller wurde mit der Qualifikation einer neuartigen Trennschicht zum mechanischen Debonden für ein bereits in Produktion befindliches Material-System begonnen. Diese neue Trennschicht ermöglichte eine Vereinfachung des Prozessablaufes und eröffnet damit Kostenvorteile im Vergleich zum aktuell eingesetzten Prozess. In Zusammenarbeit mit einem amerikanischen Materialhersteller wurden neuartige Trennschichten für das Excimerlaser-basierte Debonden auf unserem ELD300 optimiert und für unterschiedliche Kundenanwendungen aus dem 3D-Packaging-Bereich erfolgreich getestet.

Fotomasken Reinigung

Die Einführung von EUVL (Extreme Ultraviolett Lithography) für die Großserienproduktion in der Halbleiter-Industrie ist nach wie vor verzögert. Für die Industrie bedeutet das, dass die 193i Immersions-Lithographie im Mehrfachbelichtungsverfahren (Double Patterning und Quadruple Patterning) weiter ausgebaut und infolgedessen auch die damit unmittelbar verknüpften Verfahrenstechniken, wie z. B. die Fotomaskenreinigung, angepasst und erweitert werden müssen.

Im Jahr 2015 lag im Segment Fotomasken Equipment der Fokus auf sogenannten auf Megasonic basierenden Technologien. Insbesondere die Integration und Qualifizierung einer flächenbasierenden Ultraschallanwendung konnte in Kooperation mit einem wichtigen koreanischen Kunden umgesetzt und im Anschluss in das Standard-Produktportfolio übernommen werden. Auch die bei SUSS MicroTec seit Jahren im Einsatz befindliche Standard-Megasonic-Anwendung konnte nun erfolgreich im hochfrequenten Bereich getestet werden und findet sich nun ebenfalls bereits mehrfach in Kundenanlagen integriert.

Neben den für die Fotomaskenreinigung kritischen Parametern wie Partikelgröße und Wirkungsgrad, spielt auch der Erhalt der optischen Eigenschaften eine wesentliche Rolle. Transmissions- und Reflexionsgrad sowie die Veränderung der kritischen Strukturweitenverteilung auf Photomasken werden stark durch die Verwendung von konventionellen nasschemischen Verfahren beeinflusst. Schonende Trockenreinigungs- und Oberflächenbehandlungsmethoden schaffen hier weitere Möglichkeiten.

Die Entwicklung einer speziellen Plasma-Einheit war bereits Teil der Entwicklung im Jahr 2014 und wurde in einer existierenden MaskTrack PRO-Anlage bei einem taiwanesischen Kunden integriert. Im Jahr 2015 erfolgte die Qualifizierung dieser Einheit. Die Verwendung von Plasma unter Atmosphärendruck bietet hier ganz besonders viele Vorteile, da es neben dem Reinigungseffekt zusätzlich Einfluss auf die Oberflächenenergie ausübt und dadurch die Benetzbarkeit für anschließende Nassprozesse verbessert. Zudem wird mittels Plasma im Anschluss an die finale Reinigung eine Passivierung der Oberfläche erreicht.

Im Bereich von EUVL wurde offiziell das europäische Förderprojekt SeNaTe (Seven Nanometer Technologie) gestartet, bei dem auch SUSS MicroTec Projektpartner und für den Bereich Fotomaskenreinigung verantwortlich ist.

Die Holding – SÜSS MicroTec AG

Die Aufgabe der Holding ist die Steuerung und Führung des SÜSS MicroTec-Konzerns. Sie übernimmt unter anderem die Aufgaben der strategischen Ausrichtung, beispielsweise der Ausweitung des Produktportfolios, Akquisitionen und Finanzfragen der gesamten Gruppe. Ebenso ist die Holding für Corporate Identity, Investor Relations, Marketing und IT verantwortlich. Darüber hinaus übernimmt die Holding die Finanzierung von strategisch bedeutsamen Entwicklungsprojekten der operativen Tochtergesellschaften.

Die SÜSS MicroTec AG ist in der Regel alleinige Anteilseignerin an den im Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen. Ausleihungen der Holding erfolgten nur an Tochterunternehmen und deren Tochterunternehmen. Die Ertragslage der Holding als Einzelgesellschaft ist nicht direkt von der Entwicklung unserer Märkte abhängig. Die Holding refinanziert sich im Wesentlichen durch Umlage der umlagefähigen Kosten auf die operativen Gesellschaften, durch Vermietung der Gebäude an den Standorten Garching und Sternenfels an Tochtergesellschaften, durch Zinserträge aus den Ausleihungen an Tochterunternehmen sowie durch bestehende Ergebnisabführungsverträge.

Darstellung der finanziellen Kennzahlen der Holding

in Tsd. €	SMT AG (HGB)			
	2015	2014	Änderung	in %
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-8.491	6.980	-15.471	-
Eigenkapital (EK)	87.648	96.139	-8.491	-9
Bilanzsumme	137.668	139.443	-1.775	-1
EK-Quote in %	64	69		
Anlagevermögen	81.885	82.751	-866	-1
% der Bilanzsumme	59	59		
Umlaufvermögen inkl. ARAP	55.784	56.692	-908	-2
% der Bilanzsumme	41	41		

WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN DER VERMÖGENS- UND FINANZLAGE

Die immateriellen Vermögensgegenstände belaufen sich zum Stichtag unverändert auf 1,6 Mio. €.

Die Anteile an verbundenen Unternehmen sind zum Bilanzstichtag mit 51,7 Mio. € bilanziert und sind damit um 1,2 Mio. € geringer als im Vorjahr. Grund für den Rückgang sind außerplanmäßige Abschreibungen auf die Beteiligung an der SÜSS MicroTec, Inc., Corona (USA). Die Gesellschaft, die ursprünglich einen operativ tätigen Produktionsbetrieb aufwies, fungiert inzwischen lediglich als Vertriebsgesellschaft und weist dementsprechend eine

für eine Vertriebsgesellschaft übliche geringe EBIT-Marge aus. Entsprechend zeigt das zur Überprüfung der Werthaltigkeit von Finanzanlagen verwendete Modell eine Abwertung auf den Beteiligungsansatz an dieser Gesellschaft um rund 1,2 Mio. € an.

Die Ausleihungen an verbundene Unternehmen stiegen um rund 0,3 Mio. €. An die SÜSS MicroTec Photonic Systems Inc., Corona, USA, wurden weitere Darlehensbeträge ausgereicht. Zum 31. Dezember 2015 belief sich das Darlehen auf insgesamt 38,5 Mio. USD (Vorjahr: 22,6 Mio. USD). Da für die SÜSS MicroTec Photonic Systems auf Basis der aktuellen Konzernplanung ein negatives Ergebnis erwartet wird, zeigt das zur Überprüfung der Werthaltigkeit von Finanzanlagen verwendete Modell eine Abwertung dieses Gesellschafterdarlehens um rund 14,1 Mio. € an. Das Darlehen wurde entsprechend zum 31. Dezember 2015 um diesen Betrag abgewertet. Auch das an die SÜSS MicroTec KK, Yokohama, Japan, gewährte Darlehen, das sich auf 775 Mio. JPY (Vorjahr: 600 Mio. JPY) beläuft, wurde aufgrund verhaltener Ertragsaussichten der Gesellschaft abgewertet. Der zum 31. Dezember 2015 erfasste Abwertungsbetrag beläuft sich auf 1,7 Mio. €.

Die kurzfristigen Forderungen gegen verbundene Unternehmen stiegen um 0,4 Mio. € auf 14,9 Mio. € an. Der Anstieg ist im Wesentlichen stichtagsbedingt. In diesem Betrag sind die Forderungen aus den Ergebnisabführungen der SÜSS MicroTec Lithography GmbH und der SÜSS MicroTec Reman GmbH sowie der phasengleichen Gewinnvereinnahmung der SÜSS MicroTec Photomask Equipment GmbH & Co. KG enthalten.

Im Berichtsjahr sank die Liquiditätsposition der SÜSS MicroTec AG um 1,2 Mio. €. Die Reduzierung der Liquiditätsposition wird im Rückgang der Guthaben bei Kreditinstituten in Höhe von 0,2 Mio. € sichtbar. Der Bestand an Wertpapieren ist um 1,0 Mio. € auf 0 € zurückgegangen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen stiegen im Geschäftsjahr um 6,8 Mio. € auf 36,3 Mio. € an.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sanken im Verlauf des Jahres 2015 um 1,2 Mio. €. Dies resultiert aus planmäßigen Tilgungen eines Darlehens zur Finanzierung des Betriebsgrundstücks in Sternenfels und eines Darlehens zur Finanzierung des Betriebsgrundstückes in Garching.

Aufgrund des negativen Jahresergebnisses reduzierte sich das Eigenkapital der Gesellschaft von 96,1 Mio. € auf 87,6 Mio. €.

WESENTLICHE EREIGNISSE MIT EINFLUSS AUF DIE ERTRAGSLAGE DER HOLDING

Im handelsrechtlichen Jahresabschluss der SÜSS MicroTec AG ergab sich für das Geschäftsjahr 2015 ein Jahresfehlbetrag von 8,5 Mio. € (Vorjahr: Jahresüberschuss 7,0 Mio. €).

Die Umsatzerlöse der Holding beliefen sich auf 6,6 Mio. € (Vorjahr: 5,5 Mio. €) und umfassten im Wesentlichen die den Tochtergesellschaften in Rechnung gestellten Umlagen für Managementleistungen, Marketing und Versicherungen. Darüber hinaus waren in den Umsatzerlösen auch Weiterbelastungen für das konzernweite SAP-System und Lizenzgebühren enthalten.

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind überwiegend Mieterlöse in Höhe von 1,8 Mio. € (Vorjahr: 1,9 Mio. €) und Fremdwährungsgewinne in Höhe von 0,8 Mio. € (Vorjahr: 0,2 Mio. €) enthalten.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten – neben laufenden Aufwendungen für die Verwaltung – Fremdwährungsverluste in Höhe von 0,8 Mio. € (Vorjahr: 4,6 Mio. €).

Aufgrund des seit 1. Januar 2011 gültigen Ergebnisabführungsvertrages mit der SUSS MicroTec Lithography GmbH, Garching, wurde bei der Holding ein Ertrag aus Gewinnübernahme in Höhe von 6,3 Mio. € (Vorjahr: 8,8 Mio. €) ertragswirksam erfasst. Aufgrund des im Geschäftsjahr 2008 geschlossenen Ergebnisabführungsvertrages mit der SUSS MicroTec REMAN GmbH, Oberschleißheim, wurde bei der Holding ein Ertrag aus Gewinnübernahme in Höhe von 1,4 Mio. € (Vorjahr: 1,1 Mio. €) erfasst. Weiterhin wurden aus der phasengleichen Ergebnisvereinnahmung der SUSS MicroTec Photomask Equipment GmbH & Co. KG Beteiligungserträge von 1,8 Mio. € (Vorjahr: 0 €) gebucht. Darüber hinaus hat die Holding aus einer Dividendenausschüttung der SUSS MicroTec (Taiwan) Company Ltd., Hsin Chu (Taiwan) Beteiligungserträge von rund 0,7 Mio. € erzielt.

Die Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens umfassten die Zinserträge für die langfristigen Darlehen, die den Tochtergesellschaften SUSS MicroTec Photonic Systems Inc. (Corona, USA) und SUSS MicroTec KK (Yokohama, Japan) gewährt wurden.

Auf die Finanzanlagen wurden außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 16,9 Mio. € (Vorjahr: 6,9 Mio. €) vorgenommen. Davon entfielen 1,2 Mio. € auf die Beteiligung an der SUSS MicroTec, Inc. (Corona, USA) sowie 14,1 Mio. € bzw. 1,7 Mio. € auf Darlehen, die der SUSS MicroTec Photonic Systems Inc. (Corona, USA) bzw. der SUSS MicroTec KK (Yokohama, Japan) gewährt wurden.

Im Vorjahr erzielte die SÜSS MicroTec AG aus der Tilgung eines Gesellschafterdarlehens, das in der Vergangenheit der SUSS MicroTec Photomask Equipment GmbH & Co. KG gewährt wurde, einen Gewinn von 7,6 Mio. €.

Die Zinsaufwendungen stiegen im Geschäftsjahr leicht um 0,1 Mio. €, was im Wesentlichen auf erhöhte Zinsen für verbundene Unternehmen zurückzuführen ist.

In der SÜSS MicroTec AG waren im Geschäftsjahr 2015 durchschnittlich 18 (Vorjahr: 19) Mitarbeiter tätig.

Die kurz- und mittelfristige Entwicklung der SÜSS MicroTec AG hängt vor allem von der Entwicklung der Finanz- und Ertragslage wesentlicher Tochtergesellschaften ab. Die Finanz- und Ertragslage der Tochtergesellschaften ist ausschlaggebend für die Höhe des zinstragenden Nettofinanzierungssaldos der Holding und für die Ausschüttung und Abführung von Ergebnissen an die Muttergesellschaft. Zudem ist das Ergebnis beeinflusst von Fremdwährungseffekten, die sich im Wesentlichen aus der Veränderung der Wechselkurse von USD und JPY ergeben.

Der Geschäftsverlauf, die Lage sowie die voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken der SÜSS MicroTec AG als Holding unterscheiden sich nicht grundsätzlich vom Konzern. Der Jahresabschluss der SÜSS MicroTec AG wird jedoch von Bewertungseffekten im Bereich des Finanzanlagevermögens beeinflusst.

Nachhaltigkeit

Seit mehr als sechzig Jahren ist SÜSS MicroTec in der Fertigung von Anlagen und der Entwicklung von Prozesslösungen für Mikrostrukturanwendungen tätig. In unserem schnellebigen und von kurzen Innovationszyklen geprägten Geschäftsumfeld ist es notwendig, stets neue Lösungen für die Kunden zu entwickeln. Dennoch schließt sich ökologisches und ökonomisches Denken nicht aus. Nachhaltiges Wirtschaften ist ein wichtiger Erfolgsfaktor, welcher bei uns eine sehr hohe Priorität genießt. Als Technologieführer und Innovationstreiber fühlen wir uns nicht nur der Erstklassigkeit unserer Produkte, sondern auch dem Thema Nachhaltigkeit verpflichtet. Es geht bei den Managemententscheidungen immer auch darum, die sozialen, ökologischen und ökonomischen Komponenten in Einklang zu bringen. Ob mit Kunden, Mitarbeitern oder Wettbewerbern – wir streben nach einem fairen und sozial verträglichen Umgang miteinander.

Darüber hinaus legen wir die gleichen hohen Maßstäbe an Zulieferer und Geschäftspartner. Wir sind einer nachhaltigen, wirtschaftlichen Entwicklung verpflichtet und möchten den Leserinnen und Lesern auf den kommenden Seiten einen Überblick über unsere Aktivitäten im Hinblick auf eine nachhaltige Unternehmensentwicklung geben. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Internet unter ► www.suss.com ► **Unternehmen** ► **Qualitätsmanagement** ► **Nachhaltigkeit**.

COMPLIANCE

Jeder Angestellte trägt eine Mitverantwortung für das Erscheinungsbild unseres Unternehmens und dafür, dass unsere gesellschaftliche Verantwortung wahrgenommen wird. Unser Selbstverständnis umfasst zudem die Integration aller Mitarbeiter, unabhängig von Alter, Herkunft, Geschlecht, Behinderung oder Religion. Im Verhaltenskodex sind die Verhaltensregeln für SÜSS MicroTec-Mitarbeiter im Umgang mit Kunden, Zulieferern und anderen Geschäftspartnern sowie der Umgang unter den Mitarbeitern geregelt. Er soll helfen, die zahlreichen rechtlichen und ethischen Herausforderungen bei der täglichen Arbeit zu bewältigen, Orientierung zu schaffen und so das Vertrauen in die Leistung und Integrität der SÜSS MicroTec-Gruppe weiter zu stärken. Die Mitarbeiter verpflichten sich, die Verhaltensregeln des Verhaltenskodex und die Compliance-Regeln zu befolgen. Seit dem Geschäftsjahr 2014 haben wir ein webbasiertes Hinweis-System (Whistleblowing) auf mögliche Compliance-Verstöße installiert. Die Meldungen gehen per E-Mail anonymisiert oder unter freiwilliger Angabe des Namens direkt an die Rechtsabteilung.

Im Geschäftsjahr 2015 haben wir den Verhaltenskodex sowie unser Compliance-Handbuch komplett überarbeitet. Im Geschäftsjahr 2016 werden wir unseren Fokus auf das Thema Compliance weiter verstärken und werden zusätzlich Schulungen für unsere Mitarbeiter durchführen.

QUALITÄTSMANAGEMENT

Die technologisch führende Position von SÜSS MicroTec in den Bereichen Lithografie, Fotomasken Equipment, Substrat Bonder und Mikrooptik fußt auf der starken Verpflichtung zur Einhaltung höchster Qualitätsstandards. Unsere Qualitätsziele basieren auf nachhaltigem Kundenvertrauen, Wertschätzung gegenüber unseren Kunden, Partnerschaften und motivierten Mitarbeitern. SÜSS MicroTec liefert qualitativ hochwertige Produkte und Services sowie innovative Lösungen. Alle Bereiche von SÜSS MicroTec teilen unsere Verpflichtung zu höchster Qualität. Unsere Prozesse basieren auf einem effektiven Qualitätsmanagement-System, das für die Produktionsstandorte in Deutschland und der Schweiz nach ISO 9001 zertifiziert ist und ständig verbessert wird.

UMWELTVERANTWORTUNG

ISO 14001 Zertifizierung

Seit 1996 bildet die Norm ISO 14001 die Grundlage für Aufbau, Einführung, Überwachung und Weiterentwicklung von Umweltmanagement-Systemen. Sie legt entsprechende Forderungen fest, die auf Organisationen jeder Art und Größe sowie auf unterschiedliche geografische, kulturelle und soziale Bedingungen anwendbar sind. Das übergeordnete Ziel ist, den Umweltschutz zu fördern und Umweltbelastungen zu verringern – im Einklang mit wirtschaftlichen, sozialen und politischen Erfordernissen. Die ISO 14001 ist gleichzeitig auch die Grundlage für die Zertifizierung von Umweltmanagement-Systemen.

Bei SÜSS MicroTec beschäftigen wir uns im Rahmen des Umweltmanagements bereits seit 2014 intensiv mit der Vorbereitung auf die ISO 14001:2015 Zertifizierung. Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden die Vorbereitungen zur Systemanalyse sowie die Dokumentation zur Vorabprüfung erstellt. Derzeit befinden wir uns in der Vorbereitungsphase auf die eigentliche ISO-Zertifizierung, welche im Geschäftsjahr 2016 erfolgreich abgeschlossen werden soll. Durch diese Zertifizierung möchten wir auch auf internationaler Ebene ein anerkanntes Umweltmanagement-System vorweisen. Darüber hinaus kommt es während und vor dem eigentlichen Zertifizierungsprozess häufig zur Aufdeckung von Schwachstellen im Umweltmanagement-System sowie zur Aufdeckung von Rationalisierungspotenzial, welches wir zum Vorteil des Unternehmens und seiner Mitarbeiter nutzen wollen. Im Geschäftsbericht 2016 werden wir mehr zu diesem Thema berichten können.

Generalüberholung unserer Maschinen

Mit großer Sorgfalt konstruieren unsere Mitarbeiter unsere Maschinen, die häufig für eine lange Nutzungszeit ausgelegt sind. Eine Lebensdauer von bis zu 15 Jahren oder länger ist keine Seltenheit und liefert einen Beweis für die herausragende Wirtschaftlichkeit. Jahr für Jahr zeigen die Anlagen von SÜSS MicroTec ihre Qualität, Zuverlässigkeit und Belastbarkeit. Mit unserem Tochterunternehmen SÜSS MicroTec REMAN bieten wir unseren Kunden die Möglichkeit, gebrauchte, von uns sorgfältig generalüberholte Maschinen zu einem günstigeren Preis zu erwerben. Damit entlasten wir das Beschaffungsbudget unserer Kunden, verlängern die Lebensdauer gebrauchter Maschinen und sparen wertvolle Ressourcen. Die SÜSS MicroTec REMAN steuert schon seit vielen Jahren einen Beitrag zum Unternehmenserfolg bei.

Umgang mit Chemikalien

Der sorgfältige Umgang mit Chemikalien spielt insbesondere bei unseren Belackern und Entwicklern eine große Rolle. Die fortlaufende Verbesserung unserer Maschinen im Hinblick auf den Verbrauch von Nasschemikalien ist ein wichtiges Ziel unserer Entwicklungsarbeit im Unternehmen. Ein gewisser Einsatz an Nasschemie ist jedoch für die Prozessabläufe in der Halbleiterfertigung bisher zwingend notwendig.

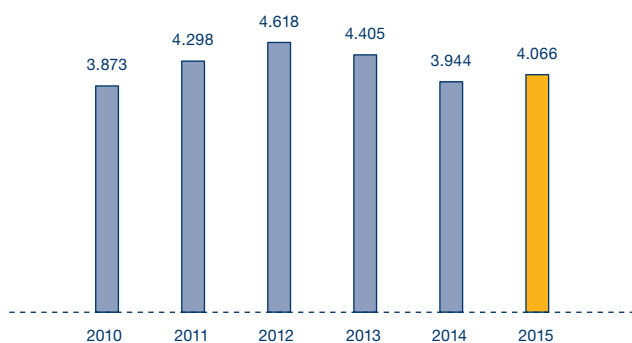
Im Garching Applikationslabor, in dem Testläufe an unseren Maschinen stattfinden, haben wir deshalb eine Neutralisationsanlage zur Abwasserbehandlung installiert, welche den pH-Wert der verschiedenen Chemikalien auf ein verträgliches Niveau anpasst.

Als Spezialmaschinenbauer im Halbleitersegment sind wir mit Produkten am Markt, die maßgeblich dazu beitragen energieeffiziente Endprodukte herzustellen und CO₂-Emissionen zu verringern. Ein Beispiel hierfür ist die Herstellung von energiesparenden Leuchtdioden (LED). Mit dem MA100/150e Gen2

bieten wir eine Mask Aligner-Plattform speziell für die Verarbeitung empfindlicher Verbindungshalbleiter, wie z. B. sehr heller LEDs (UBH).

Darüber hinaus kommen viele Bauelemente (z. B. Hochleistungsschaltkreise), die unter anderem auf unseren Maschinen gefertigt werden, in der Industrie für erneuerbare Energien wie Wind- und Solarenergie zum Einsatz. Aber auch die Verbesserungen der ökologischen Eigenschaften und der Umweltverträglichkeit unserer Produkte selbst sind ein wichtiger Teil unserer Entwicklungsarbeit. So legen wir verstärkt Wert auf einen möglichst geringen Einsatz von Chemikalien und gefährlichen Prozessmaterialien im Fertigungsprozess und während des Betriebs unserer Maschinen. Bei Belackungs- und Entwicklungsgeräten sowie Fotomasken Equipment lässt sich durch innovatives Prozessmanagement und ein ausgeklügeltes Maschinendesign der Verbrauch der verwendeten Medien reduzieren. Dies spart unseren Kunden bares Geld und entlastet die Umwelt.

Stromverbrauch Sternenfels und Garching in MWh



MITARBEITER

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie deren Wissen stellen einen erheblichen Teil unseres Unternehmenswerts dar. Unser Geschäft ist geprägt von Internationalität, globaler Ausrichtung und kultureller Vielfalt. Über den Globus verteilt haben wir Mitarbeiter in Entwicklung, Produktion, Verwaltung, Vertrieb und Service, welche ein wichtiges Netzwerk für den standortübergreifenden Wissensaustausch und die interkulturelle Zusammenarbeit bilden. Wir arbeiten in flachen Hierarchien mit kurzen Entscheidungswegen und ermöglichen unseren Mitarbeitern sich einzubringen und sich entsprechend ihrer Fähigkeiten und Neigungen weiter zu entwickeln. Denn die Motivation, das Wissen und die Flexibilität unserer Mitarbeiter sind eine wichtige Voraussetzung für den langfristigen Unternehmenserfolg.

Zum Ende des Geschäftsjahres 2015 waren 698 (Vorjahr: 659) Mitarbeiter im Konzern beschäftigt. Im gesamten Unternehmen waren zum 31. Dezember 2015 26 Auszubildende in kaufmännischen und technischen Bereichen beschäftigt (2014: 32). Seit jeher arbeitet das Unternehmen eng mit Hochschulen und Forschungseinrichtungen zusammen, um den Namen SÜSS MicroTec möglichst früh an talentierte Absolventen heranzutragen und den Nachwuchs für das erfolgreiche Bestehen des Unternehmens zu sichern.

Wir respektieren die persönliche Würde, die Privatsphäre und die Persönlichkeitsrechte jedes Einzelnen. Die Sicherheit und das Wohlbefinden der Mitarbeiter liegen uns ganz besonders am Herzen. Ein sicheres und gesundes Arbeitsumfeld fördert sowohl die Produktivität als auch das Arbeitsklima im Unternehmen. Wie in unserer Erklärung zu Umwelt, Gesundheit und Sicherheit dargelegt, ([► www.suss.com](http://www.suss.com) ► **Unternehmen** ► **Qualitätsmanagement** ► **Umweltverantwortung**) gibt es spezielle Programme, um

die höchsten Standards im Hinblick auf Sicherheit zu erfüllen. Wir führen an unseren Produktionsstandorten detaillierte Statistiken über Arbeitsunfälle und werten diese regelmäßig aus.

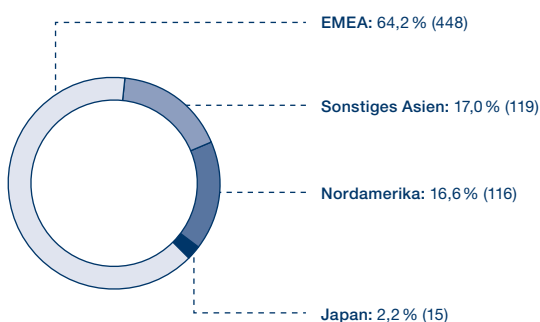
Im Geschäftsjahr 2015 wurde erstmalig ein kostenpflichtiger, mobiler Massageservice am Standort Garching getestet, welcher auf sehr positive Resonanz im Unternehmen gestoßen ist. Ab dem Geschäftsjahr 2016 wird dieser Service nun regelmäßig alle zwei Wochen für unsere Mitarbeiter zur Verfügung stehen.

Die Zusammenarbeit unserer Mitarbeiter weltweit sowie unser Umgang mit Kunden und Geschäftspartnern ist geprägt von gegenseitigem Respekt, integrem Handeln und der Einhaltung ethischer Richtlinien und Gesetze. Um die zahlreichen rechtlichen und ethischen Herausforderungen bei der täglichen Arbeit zu bewältigen, Orientierung zu schaffen und so das Vertrauen in die Leistung und Integrität der SÜSS MicroTec-Gruppe zu stärken, haben wir einen Verhaltenskodex (Code of Conduct) verabschiedet, dessen Einhaltung für alle Mitarbeiter weltweit verbindlich ist.

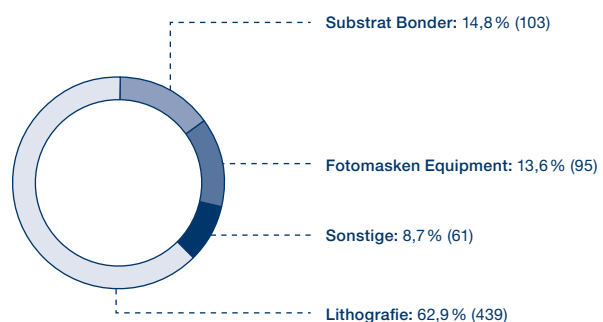
Durch das im Mai 2015 in Kraft getretene Gesetz für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Führungspositionen in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst (§ 76 Abs. 4 und § 111 Abs. 5 des AktG) sind bestimmte Gesellschaften verpflichtet, erstmals Zielgrößen für den Frauenanteil in Aufsichtsrat sowie den Vorstand und den nachfolgenden zwei Führungsebenen festzulegen. Darüber hinaus muss festgelegt werden, bis wann der jeweilige Frauenanteil erreicht werden soll.

Für die erste und zweite Führungsebene unterhalb des Vorstands hat der Vorstand der SÜSS MicroTec AG jeweils eine Zielgröße von 20% und eine Umsetzungsfrist bis zum 30. Juni 2017 beschlossen. Die Zielgröße für die erste Führungsebene

Mitarbeiter nach Regionen 2015



Mitarbeiter nach Segmenten 2015



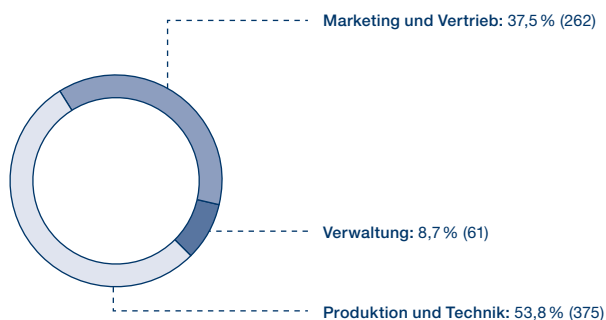
bedeutet eine Steigerung des Frauenanteils, der derzeit bei 18 % liegt. Die Zielgröße für die zweite Führungsebene bedeutet ebenso eine Steigerung von derzeit 14 %. Die Umsetzungsfrist schöpft den zulässigen Rahmen für die erstmalige Festlegung der Umsetzungsfrist aus.

KUNDENBEZIEHUNGEN

Im Umgang mit Mitarbeitern, Kunden und Geschäftspartnern legen wir großen Wert auf die Einhaltung hoher ethischer Standards. Wir sind der Meinung, dass dies entscheidend zum Unternehmenserfolg beitragen kann. Dazu gehört der korrekte Umgang mit insiderrelevanten Informationen, mit dem geistigen Eigentum der Mitarbeiter und vertraulichen Informationen von Kunden und Lieferanten.

Zu unseren Kunden zählen unter anderem namhafte Integrated Device Manufacturers (IDM) in aller Welt und zahlreiche Kunden im Bereich Outsourced Assembly and Test (OSAT). Darüber hinaus arbeiten wir seit vielen Jahren mit führenden Universitäten und Forschungsinstituten im In- und Ausland sehr erfolgreich zusammen. Im Rahmen der Entwicklung von neuen und innovativen Technologien, Maschinen und Lösungen, gehen wir zudem Partnerschaften und Kooperationen mit anderen Industrieunternehmen ein.

Mitarbeiter nach Bereichen 2015



Übernahmerechtliche Angaben gemäß § 289 Abs. 4 HGB und § 315 Abs. 4 HGB

1. Zusammensetzung des gezeichneten Kapitals

Zum 31. Dezember 2015 belief sich das gezeichnete Kapital der Gesellschaft auf 19.115.538,00 € (Vorjahr: 19.115.538,00 €). Das Grundkapital ist in 19.115.538 (Vorjahr: 19.115.538) auf Namen lautende, nennwertlose Stückaktien unterteilt, auf die ein anteiliger Betrag von 1,00 € je Aktie entfällt. Die Aktien sind voll eingezahlt.

Mit allen Aktien sind die gleichen Rechte und Pflichten verbunden. Jede Aktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme und ist maßgebend für den Anteil der Aktionäre am Gewinn der Gesellschaft. Die Rechte und Pflichten der Aktionäre ergeben sich im Einzelnen aus den Regelungen des AktG, insbesondere aus den §§ 12, 53a ff., 118 ff. und 186 AktG.

Gemäß § 67 Abs. 2 AktG gilt im Verhältnis zur Gesellschaft als Aktionär nur, wer als solcher im Aktienregister eingetragen ist. Die Aktionäre haben der Gesellschaft die zur Führung des Aktienregisters erforderlichen Daten zu übermitteln.

2. Beschränkungen, die Stimmrechte oder die Übertragung von Aktien betreffen

Beschränkungen, die Stimmrechte oder die Übertragung von Aktien betreffen, bestehen nach der Satzung nicht. Wir haben auch keine Kenntnis von dem Bestehen derartiger Vereinbarungen zwischen Aktionären.

3. Beteiligungen am Kapital, die 10 % der Stimmrechte überschreiten

Direkte oder indirekte Beteiligungen am Kapital der Gesellschaft, die 10 % der Stimmrechte erreichen oder überschreiten, sind uns nicht gemeldet worden und auch nicht bekannt.

4. Aktien mit Sonderrechten, die Kontrollbefugnisse verleihen

Aktien mit Sonderrechten, die Kontrollbefugnisse verleihen, bestehen nicht.

5. Art der Stimmrechtskontrolle, wenn Arbeitnehmer am Kapital beteiligt sind und ihre Kontrollrechte nicht unmittelbar ausüben

Soweit die SÜSS MicroTec AG im Rahmen eines Mitarbeiteraktienprogramms Aktien an Mitarbeiter ausgibt, werden die Aktien den Mitarbeitern unmittelbar übertragen. Die begünstigten Mitarbeiter können die ihnen aus den Mitarbeiteraktien zustehenden Kontrollrechte wie andere Aktionäre unmittelbar nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften und der Bestimmungen der Satzung ausüben.

6. Gesetzliche Vorschriften und Bestimmungen der Satzung über die Ernennung und Abberufung von Vorstandsmitgliedern und die Änderung der Satzung

Die Bestellung und die Abberufung von Mitgliedern des Vorstands sind in den §§ 84 und 85 AktG geregelt. Danach werden Vorstandsmitglieder vom Aufsichtsrat auf höchstens fünf Jahre bestellt. Eine wiederholte Bestellung oder Verlängerung der Amtszeit, jeweils für höchstens fünf Jahre, ist zulässig. Über die Bestellung und Abberufung von Vorstandsmitgliedern beschließt der Aufsichtsrat mit der einfachen Mehrheit der Stimmen.

Der Vorstand besteht gemäß § 7 Abs. 1 der Satzung aus mindestens zwei Personen, wobei die Zahl der Vorstandsmitglieder vom Aufsichtsrat bestimmt wird. Der Aufsichtsrat kann gemäß § 84 AktG und § 7 Abs. 2 der Satzung einen Vorsitzenden bzw. Sprecher des Vorstands sowie einen stellvertretenden Vorsitzenden bzw. Sprecher ernennen.

Fehlt ein erforderliches Vorstandsmitglied, wird das Mitglied nach § 85 AktG in dringenden Fällen auf Antrag eines Beteiligten gerichtlich bestellt. Der Aufsichtsrat kann gemäß § 84 Abs. 3 AktG die Bestellung zum Vorstandsmitglied und die Ernennung zum Vorsitzenden des Vorstands widerrufen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt.

Eine Änderung der Satzung bedarf nach § 179 AktG eines Beschlusses der Hauptversammlung. Die Befugnis zu Änderungen, die nur die Fassung betreffen, ist gemäß § 17 Abs. 3 der Satzung dem Aufsichtsrat übertragen.

Satzungsändernde Beschlüsse der Hauptversammlung bedürfen nach §§ 133 und 179 AktG in Verbindung mit § 26 Abs. 1 der Satzung der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen und einer einfachen Mehrheit des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals, soweit nicht das Gesetz zwingend eine größere Mehrheit vorschreibt.

7. Befugnisse des Vorstands, Aktien auszugeben oder zurückzukaufen

Der Vorstand ist ermächtigt, in der Zeit bis zum 21. Juni 2016 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmal oder mehrfach um bis zu insgesamt 6.500.000,00 € durch Ausgabe von bis zu 6.500.000 neuen Stückaktien gegen Baranlagen zu erhöhen. Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit der Zustimmung des Aufsichtsrats und unter Einhaltung bestimmter Bedingungen das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen.

Weiterhin ist der Vorstand ermächtigt, in der Zeit bis zum 18. Juni 2018 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrfach um bis zu insgesamt 2.500.000,00 € durch Ausgabe von bis zu 2.500.000 neuen auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen. Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats und unter Einhaltung bestimmter Bedingungen das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen.

Der Vorstand ist darüber hinaus ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 18. Juni 2018 eigene Aktien der Gesellschaft bis zu insgesamt 10 % des bei der Beschlussfassung bestehenden Grundkapitals in Höhe von 19.115.538,00 € zu erwerben. Auf die erworbenen Aktien dürfen zusammen mit anderen eigenen Aktien, die sich im Besitz der Gesellschaft befinden oder ihr nach §§ 71 a ff. AktG zuzurechnen sind, zu keinem Zeitpunkt mehr als 10 % des Grundkapitals entfallen. Die Ermächtigung darf nicht zum Zwecke des Handels in eigenen Aktien ausgeübt werden. Der Erwerb darf nach Wahl des Vorstands über die Börse oder mittels eines an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Kaufangebotes bzw. einer an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Aufforderung an die Aktionäre zur Abgabe eines Verkaufsangebotes erfolgen. Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die aufgrund dieser Ermächtigung erworbenen eigenen Aktien zu allen gesetzlich zugelassenen Zwecken zu verwenden.

8. Wesentliche Vereinbarungen der Gesellschaft, die unter der Bindung eines Kontrollwechsels infolge eines Übernahmeangebots anstehen

Mit den Banken des Konsortiums bestehen unter einem gemeinsamen Sicherheitenpool jeweils bilaterale Kreditverhältnisse, die hinsichtlich ihrer Ausgestaltung bzw. Konditionen Unterschiede aufweisen. So enthält ein Kreditverhältnis ein außerordentliches Kündigungsrecht, falls eine Änderung der Gesellschaftsverhältnisse/ ein Change-of-Control eintritt und zwischen den Parteien keine rechtzeitige Einigung über die Fortsetzung zu gegebenenfalls veränderten Konditionen, z. B. hinsichtlich der Verzinsung, der Besicherung oder sonstiger Absprachen, erzielt wurde.

Sonstige wesentliche Vereinbarungen der SÜSS MicroTec AG, die unter der Bedingung eines Kontrollwechsels infolge eines Übernahmeangebots stehen, bestehen nicht.

9. Entschädigungsvereinbarung der Gesellschaft, die für den Fall eines Übernahmeangebots mit Vorstandsmitgliedern oder Arbeitnehmern getroffen sind

Entschädigungsvereinbarungen o. ä. mit Arbeitnehmern bzw. Mitgliedern des Vorstands für den Fall eines Übernahmeangebots existieren nicht.

Zusammenfassend bestehen keine besonderen Regelungen bezüglich der mit den Anteilen verbundenen Stimmrechte und hieraus resultierenden Kontrollmöglichkeiten, weder durch Einrichtung besonderer Aktiengattungen noch durch Stimmrechts- oder Übertragungsbeschränkungen. Über die gesetzlichen Regelungen hinausgehende Vorschriften über die Bestellung oder Abberufung von Mitgliedern des Vorstands sind nicht vorhanden. Wesentliche Geschäftsbereiche oder Aktivitäten der SÜSS MicroTec AG können im Fall eines Übernahmeangebots durch vorliegende Change-of-Control-Klauseln nicht wegfallen.

Erklärung zur Unternehmensführung gemäß § 289a HGB

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec AG haben mit Datum vom 3. März 2016 eine gemeinsame Erklärung zur Unternehmensführung nach § 289a HGB abgegeben und diese auf der Internetseite der Gesellschaft unter ► <http://ir.suss.com/websites/suess/German/2010/erklaerung-zur-unternehmens-fuehrung.html> allgemein zugänglich gemacht:

Erklärung zur Unternehmensführung

RELEVANTE ANGABEN ZUR UNTERNEHMENSFÜHRUNG NACH § 289A HGB

Die Erklärung zur Unternehmensführung nach § 289a HGB ist Bestandteil des zusammengefassten Lageberichts. Gemäß § 317 Abs. 2 Satz 4 HGB sind die Angaben nach § 289a Abs. 2 HGB nicht in die Prüfung einzubeziehen; insoweit ist im Rahmen der Prüfung lediglich festzustellen, ob diese Angaben gemacht wurden. Die Erklärung zur Unternehmensführung beinhaltet die Entsprechenserklärung, Angaben zu Unternehmensführungspraktiken und die Beschreibung der Arbeitsweise von Vorstand und Aufsichtsrat. Wir verfolgen dabei das Ziel, die Darstellung der Unternehmensführung übersichtlich und prägnant zu halten.

ENTSPRECHENSERKLÄRUNG UND BERICHT-ERSTATTUNG ZUR CORPORATE GOVERNANCE

Gem. § 161 AktG sind Vorstand und Aufsichtsrat einer börsennotierten deutschen Aktiengesellschaft verpflichtet, zumindest einmal jährlich zu erklären, ob dem Deutschen Corporate Governance-Kodex entsprochen wurde und wird oder welche Empfehlungen des Kodex nicht angewendet wurden oder werden und warum nicht. Auf Basis intensiver Beratungen haben Vorstand und Aufsichtsrat am 7. Januar 2016 erklärt, dass den Empfehlungen des Deutsche Corporate Governance-Kodex in der Fassung vom 5. Mai 2015 entsprochen wird mit den folgenden Ausnahmen – Selbstbehalt bei der D&O-Versicherung, vertikaler Vergütungsausgleich, Versorgungszusagen, Bildung von Ausschüssen und Festlegung einer Regelgrenze für die Zugehörigkeitsdauer im Aufsichtsrat.

Der Wortlaut der aktuellen Entsprechenserklärung sowie alle vorhergehenden Erklärungen zum Kodex sind auf der Website des Unternehmens unter ► www.suss.com ► **Investor Relations** ► **Corporate Governance** ► **Entsprechenserklärung** veröffentlicht.

COMPLIANCE

Als international tätiges Unternehmen ist SÜSS MicroTec darauf angewiesen, durch untadeliges Verhalten das Vertrauen der Kunden und Geschäftspartner zu gewinnen und zu erhalten. Die Einhaltung von Recht, Gesetz, unternehmensinternen Richtlinien und freiwillig eingegangenen Selbstverpflichtungen sowie deren Beachtung durch die Konzernunternehmen ist bei SÜSS MicroTec wesentliche Leitungsaufgabe.

Verhaltenskodex

Um ein einheitliches vorbildliches Handeln und Verhalten zu gewährleisten, wurde für den gesamten Konzern ein Verhaltenskodex (Code of Conduct) entwickelt, der für alle Mitarbeiter des Konzerns gleichermaßen Gültigkeit besitzt und der als Leitfaden dienen soll. Der Verhaltenskodex definiert Mindeststandards und beinhaltet Hinweise für die Mitarbeiter zum Umgang mit und der Bewältigung von ethischen und rechtlichen Herausforderungen, die im Rahmen der täglichen Arbeit auftreten können. Verstöße werden im Interesse aller Mitarbeiter und des Unternehmens konsequent verfolgt und deren Ursachen beseitigt.

Compliance-Handbuch

Das gruppenweite Compliance-Programm wird darüber hinaus durch das Compliance-Handbuch, diverse Prozessregelungen sowie die für die jeweiligen Organe gültige Geschäftsordnung ergänzt. Das Compliance-Handbuch richtet sich an alle Mitarbeiter des Konzerns mit dem Ziel, ein korrektes und einheitliches Verhalten im Umgang mit vertraulichen Unternehmensdaten sicherzustellen. Insbesondere werden darin die gesetzlich geltenden Bestimmungen des Verbots der Marktmanipulation sowie die Vorgaben des Insiderrechts erläutert. Personen, die für SÜSS MicroTec tätig sind und bestimmungsgemäß Zugang zu Insiderinformationen haben, um ihre Aufgaben bei SÜSS MicroTec wahrnehmen zu können, werden gemäß den Bestimmungen des Wertpapierhandelsgesetzes in ein Insiderverzeichnis aufgenommen. Diese Personen werden über die sich daraus ergebenden rechtlichen Pflichten sowie über die Rechtsfolgen von Verstößen aufgeklärt. Den gesetzlichen Regelungen zum Verbot von Insidergeschäften wird darüber hinaus im Rahmen einer ergänzenden Insiderrichtlinie Rechnung getragen, die den Handel mit Wertpapieren des Unternehmens für Organmitglieder und Mitarbeiter innerhalb definierter Zeitfenster regelt.

ARBEITSWEISE VON VORSTAND UND AUFSICHTSRAT

SÜSS MicroTec unterliegt als deutsche Aktiengesellschaft (AG) dem deutschen Aktienrecht und verfügt daher über eine zweigeteilte Führungs- und Kontrollstruktur, die von den Mitgliedern des Vorstands und den Mitgliedern des Aufsichtsrats wahrgenommen wird. Die Unternehmensführung der SÜSS MicroTec AG ist durch eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit von Vorstand und Aufsichtsrat bestimmt. Beide Organe arbeiten im Interesse des Unternehmens und mit dem gemeinsamen Ziel eng zusammen, den Unternehmenswert nachhaltig zu steigern. Für ihre Arbeit haben sich Vorstand und Aufsichtsrat jeweils eine Geschäftsordnung gegeben.

AUFSICHTSRAT

Der Aufsichtsrat überwacht und berät den Vorstand bei der Führung der Geschäfte und bestellt die Vorstandsmitglieder. In regelmäßigen Abständen erörtert der Aufsichtsrat die Geschäftsentwicklung und Planung sowie die Strategie und deren Umsetzung. Er behandelt die Quartals- und Halbjahresberichte und billigt den Jahresabschluss der SÜSS MicroTec AG und des Konzerns unter Berücksichtigung der Prüfungsberichte des Abschlussprüfers. Zu seinen Pflichten gehört auch die Überwachung der Einhaltung der Rechtsvorschriften, behördlichen Regelungen und der unternehmensinternen Richtlinien durch das Unternehmen (Compliance). Bedeutende Geschäftsvorgänge – wie beispielsweise Akquisitionen, Desinvestitionen und Finanzmaßnahmen – sind an seine Zustimmung gebunden. Der Aufsichtsratsvorsitzende koordiniert die Arbeit im Aufsichtsrat, leitet dessen Sitzungen und nimmt die Belange des Gremiums nach außen wahr. Der Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec AG ist nicht mitbestimmt.

Der Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec AG besteht gemäß Satzung aus drei Mitgliedern. Wie es der Deutsche Corporate Governance-Kodex empfiehlt, gehören dem Aufsichtsrat eine nach dessen Einschätzung angemessene Anzahl unabhängiger Mitglieder an. Insbesondere gehört mit Dr. Stefan Reineck nicht mehr als ein ehemaliges Vorstandsmitglied dem Aufsichtsrat an, womit eine unabhängige Beratung und Überwachung des Vorstands gewährleistet ist. Die Amtsperiode des Aufsichtsrats beträgt fünf Jahre. Die laufende Amtsperiode endet mit Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung im Jahr 2017.

Entgegen den Empfehlungen des Kodex sieht der Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec AG von der Bildung von Ausschüssen ab. Der Aufsichtsrat, der seit Juni 2008 aus drei Mitgliedern besteht, ist vielmehr der Ansicht, dass die Bildung von Ausschüssen, die Zusammenarbeit und Beschlussfindung unnötig erschweren würde.

VORSTAND

Der Vorstand der SÜSS MicroTec AG besteht derzeit aus drei Mitgliedern. Die Mitglieder des Vorstands tragen gemeinsam die Verantwortung für die Führung der Geschäfte und entscheiden über Grundsatzfragen der Geschäftspolitik sowie über die Jahres- und Mehrjahresplanung. Sie entwickeln die strategische Ausrichtung des Unternehmens, stimmen diese mit dem Aufsichtsrat ab und sorgen für deren Umsetzung. Der Vorstand informiert den Aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah und umfassend über die Geschäftspolitik sowie alle für das Unternehmen relevanten Fragen der Planung, der Geschäftsentwicklung, der Risikolage und des Risikomanagements sowie der Compliance.

Darüber hinaus ist der Vorstand zuständig für die Aufstellung der Quartals- und Halbjahresabschlüsse des Unternehmens, der Jahresabschlüsse der SÜSS MicroTec AG und der Konzernabschlüsse. Der Vorstand hat ferner für die Einhaltung von Rechtsvorschriften, behördlichen Regelungen und unternehmensinternen Richtlinien zu sorgen und wirkt auf deren Beachtung durch die Konzernunternehmen hin (Compliance).

VERGÜTUNG DES AUFSICHTSRATS UND DES VORSTANDS

Die SÜSS MicroTec AG entspricht den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance-Kodex, die Vergütung für den Vorstand und den Aufsichtsrat individualisiert offen zu legen. Die Grundbezüge der Vergütungs-Systeme und die Vergütungen sind im Vergütungsbericht, der Teil des zusammengefassten Lageberichts ist, dargestellt. Im Hinblick auf die vom Corporate Governance-Kodex angestrebte „vertikale Vergütungsstruktur“ erklärt SÜSS MicroTec AG insoweit vorsorglich eine Kodexabweichung, da der Aufsichtsrat der Auffassung ist, dass die Festlegung des obersten Führungskreises und der relevanten Belegschaft unter Einbeziehung der zeitlichen Entwicklung in der Praxis zu erheblichen Rechtsunsicherheiten führen kann.

AKTIENGESCHÄFTE DER ORGANMITGLIEDER (DIRECTORS' DEALINGS)

Personen, die bei der SÜSS MicroTec AG Führungsaufgaben wahrnehmen und damit insbesondere die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats sind nach § 15 a Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) gesetzlich verpflichtet, eigene Geschäfte mit Aktien der SÜSS MicroTec AG oder sich darauf beziehenden Finanzinstrumenten, insbesondere Derivaten, offenzulegen, soweit der Wert der von dem Mitglied und ihm nahestehenden Personen innerhalb eines Kalenderjahres getätigten Geschäfte die Summe von 5.000 € zum Ende des Kalenderjahres nicht erreicht.

Alle meldepflichtigen Wertpapiergeschäfte wurden entsprechend den gesetzlichen Regelungen veröffentlicht und sind auf der Website des Unternehmens frei einsehbar unter ► www.suss.com ► **Investor Relations** ► **Die Aktie** ► **Directors' Dealings**. Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats halten 0,16 % (31.100 Stimmrechte von 19.115.538 Stimmrechten) am Grundkapital der SÜSS MicroTec AG.

FESTLEGUNG VON ZIELGRÖSSEN ZUR FÖRDERUNG DER TEILHABE VON FRAUEN AN FÜHRUNGSPPOSITIONEN

Durch das am 1. Mai 2015 in Kraft getretene „Gesetz für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Führungspositionen in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst“ (§ 76 Abs. 4 und § 111 Abs. 5 des AktG) sind börsennotierte Gesellschaften wie die SÜSS MicroTec AG unter anderem verpflichtet worden, erstmals Zielgrößen für den Frauenanteil in Aufsichtsrat, Vorstand und den nachfolgenden zwei Führungsebenen festzulegen. Darüber hinaus musste festgelegt werden, bis wann die jeweilige Zielgröße erreicht werden soll.

In Umsetzung der vorgenannten Verpflichtung hat der Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec AG am 7. September 2015 für den Frauenanteil im Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec AG eine Zielgröße von 0 % beschlossen. Damit wird der aktuelle Stand festgehalten, so dass sich die Festlegung einer Frist zur Erreichung der vorgenannten Zielgröße erübrigte.

Der Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec AG hat am 7. September 2015 für den Frauenanteil im Vorstand der SÜSS MicroTec AG eine Zielgröße von 0 % beschlossen. Damit wird der aktuelle Stand festgehalten, so dass sich auch insoweit die Festlegung einer Frist zur Erreichung der vorgenannten Zielgröße erübrigte.

Für die erste und zweite Führungsebene unterhalb des Vorstands hat der Vorstand der SÜSS MicroTec AG am 2. September 2015 jeweils eine Zielgröße von 20 % und eine Umsetzungsfrist bis zum 30. Juni 2017 beschlossen. Die Zielgröße für die erste Führungsebene bedeutet eine Steigerung des Frauenanteils, der zum Zeitpunkt der Beschlussfassung bei 18 % lag. Die Zielgröße für die zweite Führungsebene bedeutet ebenso eine Steigerung, da der Frauenanteil zum Zeitpunkt der Beschlussfassung bei 14 % lag. Die Umsetzungsfrist schöpft den zulässigen Rahmen für die erstmalige Festlegung der Umsetzungsfrist aus. Zum 31. Dezember 2015 liegt der Frauenanteil im Rahmen der ersten Führungsebene weiterhin bei 18 %, der Frauenanteil im Rahmen der zweiten Führungsebene bei 14 %.

AKTIONÄRE UND HAUPTVERSAMMLUNG

Die Aktionäre der SÜSS MicroTec AG üben ihre Mitbestimmungs- und Kontrollrechte auf der mindestens einmal jährlich stattfindenden Hauptversammlung aus. Jede Aktie der SÜSS MicroTec gewährt eine Stimme. Sämtliche, für die Entscheidungsfindung notwendigen Unterlagen sind entsprechend den aktienrechtlichen Vorschriften auf der Website des Unternehmens veröffentlicht und können ebenfalls in Kopie beim Unternehmen angefordert werden.

Jeder Aktionär, der im Aktienregister eingetragen ist und sich rechtzeitig anmeldet, ist zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts berechtigt. Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen können, haben die Möglichkeit ihr Stimmrecht durch ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung, die von der Gesellschaft eingesetzten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter oder durch einen Bevollmächtigten ihrer Wahl ausüben zu lassen. Weisungen zur Stimmrechtsausübung können schriftlich im Vorfeld oder während der Hauptversammlung direkt vor Ort erteilt werden.

RECHNUNGSLEGUNG UND ABSCHLUSSPRÜFUNG

SÜSS MicroTec erstellt den Konzernabschluss sowie die Zwischenberichte nach den International Financial Reporting Standards (IFRS), wie sie in der Europäischen Union für börsennotierte Gesellschaften anzuwenden sind. Der Konzernabschluss wird vom Vorstand aufgestellt, vom Abschlussprüfer geprüft und vom Aufsichtsrat gebilligt. Der Einzelabschluss der SÜSS MicroTec AG wird nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) erstellt, vom Abschlussprüfer geprüft und vom Aufsichtsrat festgestellt.

Am 2. Juni 2015 bestellte die Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2015 die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit Sitz in Hamburg, Zweigniederlassung München, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer der SÜSS MicroTec AG. Als Nachweis seiner Unabhängigkeit hat der Abschlussprüfer gegenüber dem Aufsichtsrat eine Unabhängigkeitserklärung abgegeben. Des Weiteren wurde mit dem Abschlussprüfer vereinbart, dass dieser den Aufsichtsrat über alle wesentlichen Feststellungen und Vorkommnisse informiert, die sich bei der Durchführung der Abschlussprüfung ergeben.

RISIKOMANAGEMENT

Der verantwortungsbewusste Umgang mit geschäftlichen Risiken gehört zu den Grundsätzen guter Corporate Governance. Zur Erkennung und Steuerung von Risiken sowie zur Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen ist ein Risikomanagement-System seit langem Bestandteil der Unternehmensführung bei SÜSS MicroTec. Dieses wird im Rahmen der Jahresabschlussprüfung jährlich geprüft.

Die Organisation des Risikomanagements orientiert sich an der funktionellen und hierarchischen Struktur des Konzerns. Mit der Einführung des Risikomanagement-Systems wurde ein Risikomanagement-Beauftragter ernannt, der alle drei Monate direkt an den Vorstand berichtet. Der Vorstand seinerseits informiert den Aufsichtsrat regelmäßig über bestehende Risiken und deren Entwicklung.

Einzelheiten zum Risikomanagement im SÜSS MicroTec-Konzern sind im Risikobericht, der Teil des Lageberichts ist, dargestellt. Hierin ist der Bericht zum rechnungslegungsbezogenen internen Kontroll- und Risikomanagement-System gemäß Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) enthalten.

TRANSPARENZ

Die SÜSS MicroTec informiert Aktionäre, Analysten, Aktionärsvereinigungen, Medien und die interessierte Öffentlichkeit regelmäßig und zeitnah über die aktuelle Geschäftsentwicklung und die Lage des Konzerns. Die verschiedenen Zielgruppen werden dabei gleichzeitig und gleichberechtigt behandelt. Alle kapitalmarktrelevanten Informationen sind zudem auf der Website des Unternehmens veröffentlicht und frei einsehbar. Die wesentlichen wiederkehrenden Termine und Ereignisse sind im Finanzkalender des Unternehmens zusammengestellt. Dieser wird mit ausreichend zeitlichem Vorlauf veröffentlicht und ist auf der Website des Unternehmens einsehbar unter ► www.suss.com ► [Investor Relations](#) ► [Finanzkalender](#).

Vergütungsbericht

Vergütung des Vorstands

SÜSS MicroTec legt die Vorstandsvergütung bereits seit mehreren Jahren individualisiert offen. Ziel des Systems der Vorstandsvergütung bei SÜSS MicroTec ist es, einen Anreiz für die langfristige und auf Nachhaltigkeit angelegte Unternehmensführung zu setzen. Besondere Leistungen sollen besonders vergütet werden. Aber auch Zielverfehlungen müssen zu einer spürbaren Verringerung der Vergütung führen; darüber hinaus muss sich die Vergütung an der Größe und der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens orientieren. Die Gesamtvergütung der Vorstandsmitglieder besteht aus erfolgsunabhängigen und erfolgsbezogenen Vergütungsbestandteilen.

Für die Festlegung der Vorstandsvergütung ist der Aufsichtsrat zuständig. Das Aufsichtsratsplenum beschließt und überprüft auf regelmäßiger Basis das Vergütungs-System für den Vorstand und beschließt über die Vorstandsverträge.

Der Aufsichtsrat hat sich eingehend mit der Ausrichtung der Vorstandsvergütung an einer nachhaltigen Unternehmensführung befasst. Hierzu wurde auch ein externer Vergütungsberater hinzugezogen.

FESTE VERGÜTUNG

Die Höhe der Festbezüge wird in erster Linie von der übertragenen Funktion bzw. der Verantwortung bestimmt. Die erfolgsunabhängigen Teile der Vergütung bestehen aus dem Grundgehalt sowie Nebenleistungen in Form eines Dienstwagens und Zuschüssen zur Krankenversicherung sowie zur freiwilligen Rentenversicherung. Darüber hinaus sind einzelnen Mitgliedern des Vorstands Versorgungszusagen (Alters-, Berufsunfähigkeits- und Witwenrente) in Form von Direktversicherungen (Kapitallebensversicherungen) gemacht worden.

ERFOLGSBEZOGENE VERGÜTUNG

Die erfolgsbezogene Vergütung besteht aus einer variablen Vergütung.

VARIABLE VERGÜTUNG

Die variable Vergütung kann seit dem 1. Januar 2012 höchstens 150 % der Festvergütung zu Beginn des betreffenden Geschäftsjahres betragen. Diese Regelung findet im Geschäftsjahr 2015 Anwendung für Herrn Knopp und Herrn Braun. Für Herrn Hansson kann die variable Vergütung höchstens 110 % der Festvergütung zu Beginn des betreffenden Geschäftsjahres

betragen. Diese Regelung gilt auch für künftige Geschäftsjahre. Mit Wirkung 1. Januar 2016 kann die variable Vergütung für Herrn Knopp und Herrn Braun höchstens 100 % der Festvergütung zu Beginn des betreffenden Geschäftsjahres betragen.

70 % der variablen Vergütung bestimmen sich nach Jahreszielen und 30 % nach Mehrjahreszielen. Da Herr Hansson für das Geschäftsjahr 2015 eine garantierte Tantieme erhält, wurden für ihn keine Jahresziele bzw. Mehrjahresziele vereinbart.

AN JAHRESZIELEN ORIENTIERTE VARIABLE VERGÜTUNG (VARIABLE VERGÜTUNG A)

Die Jahresziele (Auftragseingang, Umsatz, EBITDA und Free Cashflow) werden für jeweils ein Geschäftsjahr vom Aufsichtsrat festgelegt. Werden diese Ziele zu 70 % oder weniger erreicht, entfällt diese Vergütungskomponente. Bei einer Zielerreichung von 130 % ist der Maximalbetrag erreicht. Beträgt der Zielerreichungsgrad für ein bestimmtes Ziel zwischen 70 % und 130 %, ist der entsprechende anteilige Betrag an der variablen Vergütung im Verhältnis zum Zielerreichungsgrad zu ermitteln.

Die an Jahreszielen orientierte Vergütung wird jährlich ermittelt. Im Interesse einer Förderung der langfristigen Unternehmensentwicklung steht den Vorstandsmitgliedern aber nur die Hälfte der variablen Vergütung A endgültig zu. In Bezug auf die andere Hälfte des Auszahlungsbetrages (Vorbehaltshälfte) ist das Vorstandsmitglied verpflichtet, in dem ersten Handelsfenster nach Auszahlung des Auszahlungsbetrages Aktien der Gesellschaft zu erwerben und für eine Sperrfrist von drei Jahren, gerechnet ab dem letzten Tag des Handelsfensters, in dem die Aktien erworben wurden, in einem auf seinen Namen lautenden Depot zu halten.

AN MEHRJAHRESZIELEN ORIENTIERTE VARIABLE VERGÜTUNG (VARIABLE VERGÜTUNG B)

30 % der variablen Vergütung entfallen auf mehrjährige Ziele, die für einen Zeitraum von regelmäßig drei Geschäftsjahren festgelegt werden.

Erstmalig erfolgte eine Festlegung der Mehrjahresziele für die Geschäftsjahre 2010 bis 2012. Für die Geschäftsjahre 2013 bis 2015 erfolgte die erneute Festlegung von Mehrjahreszielen für drei Geschäftsjahre im Voraus, wobei diese sich nach Funktion und Aufgabenbereich des Vorstandsmitglieds unterscheiden können. Die derzeitigen Mehrjahresziele beziehen sich auf die Erreichung festgelegter EBIT-Margen bzw. Meilensteine

von Entwicklungsprojekten in definierten Zeiträumen. Werden diese Ziele zu 70 % oder weniger erreicht, entfällt diese Vergütungskomponente. Bei einer Zielerreichung von 150 % ist der Maximalbetrag erreicht. Beträgt der Zielerreichungsgrad für ein bestimmtes Ziel zwischen 70 % und 150 %, ist der entsprechende anteilige Betrag an der variablen Vergütung im Verhältnis zum Zielerreichungsgrad zu ermitteln. Die an Mehrjahreszielen orientierte variable Vergütung B wird jährlich ermittelt und für das jeweilige Geschäftsjahr vollständig ausgezahlt.

ABFINDUNGEN

In Vorstandsverträgen ist für den Fall, dass die Vorstandstätigkeit ohne wichtigen Grund vorzeitig endet, eine Ausgleichszahlung vorgesehen. Diese ist auf maximal zwei Jahresvergütungen einschließlich Nebenleistungen begrenzt (Abfindungs-Cap) und vergütet nicht mehr als die Restlaufzeit des jeweiligen Anstellungsvertrages. Eine Zusage für Leistungen aus Anlass der vorzeitigen Beendigung der Vorstandstätigkeit infolge eines Kontrollwechsels (Change-of-Control-Regelung) ist in den bestehenden Vorstandsverträgen nicht enthalten.

VORSTANDSVERGÜTUNG

Die im Folgenden aufgeführten Tabellen zur Vorstandsvergütung entsprechen dem Deutschen Corporate Governance-Kodex. Die Festvergütung und die Nebenleistungen richten sich nach dem vereinbarten Festbetrag. Für die variable Vergütung ist sowohl ein Zielwert für eine Erreichung von 100 % angegeben als auch die erreichbare Minimal- und Maximalvergütung.

Für die Geschäftsjahre 2014 und 2015 beträgt die Tantieme von Herrn Braun jeweils mindestens 35.625,00 €. Für das Geschäftsjahr 2015 erhält Herr Hansson eine garantierte Tantieme von 186.667,00 €.

HÖHE DER VORSTANDSVERGÜTUNG

Die folgenden Tabellen („Gewährte Zuwendungen“ und „Zufluss“) zeigen die Vergütung für die Geschäftsjahre 2015 und 2014 je Vorstandsmitglied gemäß den Anforderungen des Deutschen Corporate Governance-Kodex Ziffer 4.2.5 Abs. 3. Die Angaben, die bisher gemäß § 314 HGB in der Tabelle „Vorstandsvergütung“ enthalten waren, sind nun in der Tabelle „Zufluss“ abgebildet.

Zielvergütung des Vorstands nach dem Deutschen Corporate Governance-Kodex:

in €	Dr. Per-Ove Hansson			
	Vorstandsvorsitzender CEO, Eintritt 01.05.2015			
Gewährte Zuwendungen	2014	2015 (100 %)	2015 (Min)	2015 (Max)
Festvergütung	–	233.336,00	233.336,00	233.336,00
Wechselprämie ¹	–	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Nebenleistungen (fix) ²	–	44.850,10	44.850,10	44.850,10
Aufwand für Altersversorgung ³	–	–	–	–
Summe	–	378.186,10	378.186,10	378.186,10
Einjährige variable Vergütung (A) ⁴	–	130.666,90	130.666,90	130.666,90
davon Investition in SÜSS MicroTec-Aktien ⁵	–	65.333,45	65.333,45	65.333,45
Mehrjährige variable Vergütung (B) (2013–2015)	–	56.000,10	56.000,10	56.000,10
Summe	–	564.853,10	564.853,10	564.853,10
Versorgungsaufwand	–	–	–	–
Gesamtvergütung	–	564.853,10	564.853,10	564.853,10

¹ Die Wechselprämie von 200.000 € kommt in zwei Tranchen zur Auszahlung im Mai 2015 und im Mai 2016.

² enthält: Zuschuss freiwillige Rentenversicherung
Geldwerter Vorteil Pkw
Unternehmensanteil gesetzliche oder private Krankenkasse
Zuschuss Umzug und Mehrkosten Wohnung (befristet auf sechs Monate)

³ Aufwand für Altersversorgung (Direktversicherung)

⁴ Variable Vergütung (einjährig und mehrjährig) maximal 150 % der Festvergütung des betreffenden Geschäftsjahres

⁵ Für die im Rahmen der variablen Vergütung erworbenen Aktien gilt eine Sperrfrist von drei Jahren.

Michael Knopp
Finanzvorstand CFO

in €

Gewährte Zuwendungen	2014	2015 (100 %)	2015 (Min)	2015 (Max)
Festvergütung	251.254,00	268.339,00	268.339,00	268.339,00
Wechselprämie ¹	–	–	–	–
Nebenleistungen (fix) ²	21.502,56	21.646,08	21.646,08	21.646,08
Aufwand für Altersversorgung ³	2.148,00	2.148,00	2.148,00	2.148,00
Summe	274.904,56	292.133,08	292.133,08	292.133,08
Einjährige variable Vergütung (A) ⁴	128.625,00	136.500,00	–	273.000,00
davon Investition in SÜSS MicroTec-Aktien ⁵	64.312,50	68.250,00	–	136.500,00
Mehrjährige variable Vergütung (B) (2013–2015)	55.125,00	58.500,00	–	117.000,00
Summe	458.654,56	487.133,08	292.133,08	682.133,08
Versorgungsaufwand	–	–	–	–
Gesamtvergütung	458.654,56	487.133,08	292.133,08	682.133,08

¹ Die Wechselprämie von 200.000 € kommt in zwei Tranchen zur Auszahlung im Mai 2015 und im Mai 2016.

² enthält: Zuschuss freiwillige Rentenversicherung
Geldwerter Vorteil Pkw
Unternehmensanteil gesetzliche oder private Krankenkasse
Zuschuss Umzug und Mehrkosten Wohnung (befristet auf sechs Monate)

³ Aufwand für Altersversorgung (Direktversicherung)

⁴ Variable Vergütung (einjährig und mehrjährig) maximal 150 % der Festvergütung des betreffenden Geschäftsjahres

⁵ Für die im Rahmen der variablen Vergütung erworbenen Aktien gilt eine Sperrfrist von drei Jahren.

Walter Braun
Produktionsvorstand COO, Eintritt: 01.07.2014

in €

Gewährte Zuwendungen	2014	2015 (100 %)	2015 (Min)	2015 (Max)
Festvergütung	94.998,00	189.996,00	189.996,00	189.996,00
Wechselprämie ¹	–	–	–	–
Nebenleistungen (fix) ²	9.993,66	20.093,88	20.093,88	20.093,88
Aufwand für Altersversorgung ³	–	–	–	–
Summe	104.991,66	210.089,88	210.089,88	210.089,88
Einjährige variable Vergütung (A) ⁴	49.875,00	99.750,00	35.625,00	199.500,00
davon Investition in SÜSS MicroTec-Aktien ⁵	24.937,50	49.875,00	17.812,50	99.750,00
Mehrjährige variable Vergütung (B) (2013–2015)	21.375,00	42.750,00	–	85.500,00
Summe	176.241,66	352.589,88	245.714,88	495.089,88
Versorgungsaufwand	–	–	–	–
Gesamtvergütung	176.241,66	352.589,88	245.714,88	495.089,88

¹ Die Wechselprämie von 200.000 € kommt in zwei Tranchen zur Auszahlung im Mai 2015 und im Mai 2016.

² enthält: Zuschuss freiwillige Rentenversicherung
Geldwerter Vorteil Pkw
Unternehmensanteil gesetzliche oder private Krankenkasse
Zuschuss Umzug und Mehrkosten Wohnung (befristet auf sechs Monate)

³ Aufwand für Altersversorgung (Direktversicherung)

⁴ Variable Vergütung (einjährig und mehrjährig) maximal 150 % der Festvergütung des betreffenden Geschäftsjahres

⁵ Für die im Rahmen der variablen Vergütung erworbenen Aktien gilt eine Sperrfrist von drei Jahren.

Frank Averdung

Vorstandsvorsitzender CEO, Austritt: 24.08.2014

in €

Gewährte Zuwendungen	2014	2015 (100 %)	2015 (Min)	2015 (Max)
Festvergütung	330.000,00	–	–	–
Wechselprämie ¹	–	–	–	–
Nebenleistungen (fix) ²	23.789,28	–	–	–
Aufwand für Altersversorgung ³	2.148,00	–	–	–
Summe	355.937,28	–	–	–
Einjährige variable Vergütung (A) ⁴	173.250,00	–	–	–
davon Investition in SÜSS MicroTec-Aktien ⁵	86.625,00	–	–	–
Mehrjährige variable Vergütung (B) (2013–2015)	74.250,00	–	–	–
Summe	603.437,28	–	–	–
Versorgungsaufwand	–	–	–	–
Gesamtvergütung	603.437,28	–	–	–

¹ Die Wechselprämie von 200.000 € kommt in zwei Tranchen zur Auszahlung im Mai 2015 und im Mai 2016.

² enthält: Zuschuss freiwillige Rentenversicherung
Geldwerter Vorteil Pkw
Unternehmensanteil gesetzliche oder private Krankenkasse
Zuschuss Umzug und Mehrkosten Wohnung (befristet auf sechs Monate)

³ Aufwand für Altersversorgung (Direktversicherung)

⁴ Variable Vergütung (einjährig und mehrjährig) maximal 150 % der Festvergütung des betreffenden Geschäftsjahres

⁵ Für die im Rahmen der variablen Vergütung erworbenen Aktien gilt eine Sperrfrist von drei Jahren.

Zufluss der Vorstandsvergütung nach dem Deutschen Corporate Governance-Kodex:

Dr. Per-Ove Hansson
Vorstandsvorsitzender CEO,
Eintritt 01.05.2015

Michael Knopp
Finanzvorstand CFO

in €

Zufluss	2014	2015	2014	2015
Festvergütung	–	233.336,00	251.254,00	268.339,00
Wechselprämie ¹	–	100.000,00	–	–
Nebenleistungen (fix) ²	–	44.850,10	21.502,56	21.646,08
Aufwand für Altersversorgung ³	–	–	2.148,00	2.148,00
Abfindungszahlungen	–	–	–	–
Summe	–	378.186,10	274.904,56	292.133,08
Einjährige variable Vergütung (A) ⁴	–	130.666,90	191.758,96	252.429,75
davon Investition in SÜSS MicroTec-Aktien ⁵	–	65.333,45	95.879,48	126.214,87
Mehrjährige variable Vergütung (B) (2013–2015)	–	56.000,10	104.107,89	–
Summe	–	564.853,10	570.771,41	544.562,83
Versorgungsaufwand	–	–	–	–
Gesamtvergütung	–	564.853,10	570.771,41	544.562,83

¹ Die Wechselprämie von 200.000 € kommt in zwei Tranchen zur Auszahlung im Mai 2015 und im Mai 2016.

² enthält: Zuschuss freiwillige Rentenversicherung
Geldwerter Vorteil Pkw
Unternehmensanteil gesetzliche oder private Krankenkasse
Zuschuss Umzug und Mehrkosten Wohnung (befristet auf sechs Monate)

³ Aufwand für Altersversorgung (Direktversicherung)

⁴ Variable Vergütung (einjährig und mehrjährig) maximal 150 % der Festvergütung des betreffenden Geschäftsjahres

⁵ Für die im Rahmen der variablen Vergütung erworbenen Aktien gilt eine Sperrfrist von drei Jahren.

in €	Walter Braun Produktionsvorstand COO, Eintritt: 01.07.2014		Frank Averdung Vorstandsvorsitzender CEO, Austritt: 24.08.2014	
	2014	2015	2014	2015
Zufluss				
Festvergütung	94.998,00	189.996,00	330.000,00	–
Wechselprämie ¹	–	–	–	–
Nebenleistungen (fix) ²	9.993,66	20.093,88	23.789,28	–
Aufwand für Altersversorgung ³	–	–	2.148,00	–
Abfindungszahlungen	–	–	930.000,00	–
Summe	104.991,66	210.089,88	1.285.937,28	–
Einjährige variable Vergütung (A) ⁴	74.355,51	184.467,89	120.000,00	–
davon Investition in SÜSS MicroTec-Aktien ⁵	37.177,76	92.233,95	–	–
Mehrfährige variable Vergütung (B) (2013–2015)	16.648,99	64.125,00	–	–
Summe	195.996,16	458.682,77	1.405.937,28	–
Versorgungsaufwand	–	–	–	–
Gesamtvergütung	195.996,16	458.682,77	1.405.937,28	–

¹ Die Wechselprämie von 200.000 € kommt in zwei Tranchen zur Auszahlung im Mai 2015 und im Mai 2016.

² enthält: Zuschuss freiwillige Rentenversicherung
Geldwerter Vorteil Pkw
Unternehmensanteil gesetzliche oder private Krankenkasse
Zuschuss Umzug und Mehrkosten Wohnung (befristet auf sechs Monate)

³ Aufwand für Altersversorgung (Direktversicherung)

⁴ Variable Vergütung (einjährig und mehrjährig) maximal 150 % der Festvergütung des betreffenden Geschäftsjahres

⁵ Für die im Rahmen der variablen Vergütung erworbenen Aktien gilt eine Sperrfrist von drei Jahren.

PENSIONEN

Es bestehen keine Pensionsrückstellungen für Mitglieder oder ehemalige Mitglieder des Vorstands.

Vergütung des Aufsichtsrats

Die Vergütung des Aufsichtsrats ist in § 19 der Satzung der SÜSS MicroTec AG geregelt. Neben der Erstattung ihrer Auslagen und einem Sitzungsgeld von 2.000,00€ pro Sitzung erhält jedes Aufsichtsratsmitglied eine feste Vergütung, die sich an der Verantwortung und dem Tätigkeitsumfang der Aufsichtsratsmitglieder orientiert. Demnach erhält der Vorsitzende des Aufsichtsrats 60.000,00€, sein Stellvertreter 50.000,00€ und ein einfaches Mitglied des Aufsichtsrats 45.000,00€ pro Geschäftsjahr als feste Vergütung. Die Mitglieder des Aufsichtsrats haben der Gesellschaft den rechnerischen Pro-Kopf-Anteil der von der Gesellschaft gezahlten D&O-Versicherungsprämie erstattet.

2015 in €	Vergütung	Sitzungsgeld	Abzug für anteilige D&O-Versicherungsprämie
Aufsichtsrat			
Dr. Stefan Reineck (Aufsichtsratsvorsitzender)	60.000,00	12.000,00	1.655,18
Jan Teichert (Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender)	50.000,00	12.000,00	827,59
Gerhard Pegam	45.000,00	12.000,00	551,73

2014 in €	Vergütung	Sitzungsgeld	Abzug für anteilige D&O-Versicherungsprämie
Aufsichtsrat			
Dr. Stefan Reineck (Aufsichtsratsvorsitzender)	45.000,00	13.500,00	1.914,82
Jan Teichert (Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender)	40.000,00	13.500,00	957,41
Gerhard Pegam	35.000,00	12.000,00	638,27

Im Geschäftsjahr 2015 haben weder die Mitglieder des Aufsichtsrats noch ihnen nahestehende Personen oder Unternehmen eine Vergütung bzw. Vorteile für persönlich erbrachte Leistungen, insbesondere Beratungs- und Vermittlungsleistungen, erhalten.

Nachtragsbericht

Bericht zu wesentlichen Ereignissen nach Ende des Geschäftsjahres

Wesentliche Ereignisse nach dem Stichtag, die einen signifikanten Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- oder Ertragslage des Konzerns haben, haben sich nicht ergeben.

Die Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main, Deutschland, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 28. Januar 2016 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 25. Januar 2016

die Schwelle von 5 % unterschritten hat und zu diesem Tag 4,86 % beträgt (929.356 Stimmrechte). Davon sind ihr 4,86 % (929.356 Stimmrechte) nach § 22 WpHG zuzurechnen.

Die Dimensional Holdings Inc., Austin, Texas, USA, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 3. März 2016 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 25. Februar 2016 die Schwelle von 3 % überschritten hat und zu diesem Tag 3,004 % beträgt (574.300 Stimmrechte). Davon sind ihr 3,004 % (574.300 Stimmrechte) nach § 22 WpHG zuzurechnen.

Potenziale

Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung des SÜSS MicroTec-Konzerns

Unser Chancen- und Risikomanagement zielt darauf ab, den Unternehmenswert des SÜSS MicroTec-Konzerns nachhaltig zu sichern und zu steigern. Zu unserer unternehmerischen Zielsetzung gehören das frühzeitige und erfolgreiche Erkennen von Chancen sowie die Identifikation und angemessene Bewertung der damit verbundenen Risiken und die adäquate Reaktion darauf. Die vielfältigen Chancen für unseren Konzern resultieren aus der Technologieführerschaft in unseren Geschäftsfeldern, unserem breiten Spektrum an Produkten und Lösungen für die Halbleiter-Equipment-Industrie, den Kooperationen mit internationalen Kunden und Forschungsinstituten sowie unserer globalen Ausrichtung.

Chancen und Risiken definieren wir wie folgt:

- Chancen sind mögliche künftige Entwicklungen oder Ereignisse, die zu einer für den Konzern positiven Prognose- bzw. Zielabweichung führen können.
- Unter Risiken verstehen wir mögliche künftige Entwicklungen oder Ereignisse, die zu einer für den Konzern negativen Prognose- bzw. Zielabweichung führen können.

Die Analyse und Beurteilung der Chancen und Risiken des Konzerns ist Gegenstand fortlaufender Betrachtungen durch den Vorstand und das Management des Konzerns. Auf der Grundlage eines chancenorientierten, gleichzeitig aber risikobewussten Managements ist es jedoch nicht unser Ziel, alle potenziellen Risiken grundsätzlich zu vermeiden. Vielmehr streben wir stets ein Optimum aus Risikovermeidung, -reduzierung und kontrollierter Risikoakzeptanz an. Das Bewusstsein für Risiken sollte nicht die Fähigkeit beeinträchtigen, Chancen zu erkennen und zum Wohle des Unternehmens und seiner Aktionäre zu nutzen.

CHANCEN DES KONZERNS

Die globale Geschäftstätigkeit des SÜSS MicroTec-Konzerns innerhalb eines dynamischen Marktumfelds eröffnet ständig neue Chancen, die das angestrebte Wachstum von SÜSS MicroTec unterstützen und vorantreiben können. Das Erkennen und Nutzen dieser Chancen gehört daher zu den wesentlichen Bestandteilen unserer Wachstumspolitik.

Gesamtwirtschaftliche Chancen

SÜSS MicroTec ist mit Produktions-, Verkaufs- und Service-Niederlassungen weltweit vertreten und arbeitet darüber hinaus mit vielen externen Handelspartnern zusammen. Durch die internationale Präsenz bieten sich dem Konzern zahlreiche Chancen, weltweit neue Kunden zu akquirieren, neue Kooperationen einzugehen und an dem Wachstum der Industriemärkte in den bedeutenden und aufstrebenden Volkswirtschaften teilzuhaben.

Unternehmensstrategische Chancen

SÜSS MicroTec hat in der Herstellung von Prozessausrüstungen für die Halbleiter-Industrie Standards in Präzision und Qualität gesetzt. Kontinuierliche Innovationsleistungen und die Fähigkeit, stets neue Lösungen in einem sich schnell ändernden Umfeld bereit zu stellen, haben SÜSS MicroTec zum Technologieführer gemacht. Diese Stärken zusammen mit einer soliden finanziellen Ausstattung geben dem Konzern die Möglichkeit, aussichtsreiche Entwicklungsprojekte durchzuführen, erfolgsversprechende Kooperationen einzugehen und damit die Produktpalette weiter auszubauen sowie Anwendungen und Technologien weiterzuentwickeln. Der SÜSS MicroTec-Konzern pflegt zahlreiche Entwicklungspartnerschaften mit Forschungsinstituten und Universitäten. Insbesondere die Zusammenarbeit mit Forschungsinstituten bietet großes Potenzial für SÜSS MicroTec, denn diese arbeiten in der Regel sehr eng mit unseren Kunden zusammen und werden zu einem nicht unerheblichen Anteil durch die Kunden finanziert. Neue Basistechnologien werden häufig in den Laboren der Forschungsinstitute entwickelt und finden dann erst ihren Weg in die Industrie. Umso wichtiger ist es für ein Hightech-Unternehmen wie SÜSS MicroTec, von Anfang an in die Neuentwicklung von Technologien und Prozessen mit eingebunden zu sein. Dies erhöht die Chancen, später Maschinen und Lösungen für das industrielle Umfeld in der Volumenproduktion liefern zu können.

Neben der Weiterentwicklung eigener Technologien sieht SÜSS MicroTec grundsätzlich auch die Chance, den Konzern durch Akquisition von außen um neue Geschäftsfelder und Technologien zu erweitern.

Branchen- und marktspezifische Chancen

Die von SÜSS MicroTec bedienten Märkte der Halbleiter-Equipment-Industrie unterliegen einem stetigen Wandel, der vor allem durch die rasanten Entwicklungen im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie beeinflusst wird. So ist die weltweit immer weiter steigende Anzahl von Smartphones und Tablet-Computern ein wesentlicher Wachstumstreiber für die Hersteller dieser Produkte. 2015 wurden in Deutschland 26,2 Millionen Smartphones verkauft, das ist ein Plus von 7,4 % gegenüber dem Vorjahr. Der Umsatz in Deutschland stieg sogar um 22 % auf 10,3 Mrd. € und knackte damit erstmals die symbolische Marke von 10 Mrd. €. Das berichtet der Digitalverband Bitkom auf Grundlage aktueller Prognosen des European Information Technology Observatory (EITO)¹. Der Smartphone-Boom

wird Bitkom-Prognosen zufolge auch 2016 weitergehen. Für Deutschland wird ein Absatz von voraussichtlich 28,2 Millionen Geräten erwartet, das wäre ein erneutes Plus von 7,5 % gegenüber 2015.

Auch das weltweite Wachstum ist ungebrochen. So wurden im vierten Quartal 2014 weltweit erstmals mehr als 300 Millionen Smartphones verkauft. In den ersten drei Quartalen 2015 setzte sich dieser Wachstumstrend fort – in allen drei Quartalen lag der Smartphone-Absatz jeweils deutlich über der 300-Millionen-Marke².

Darüber hinaus sorgt auch die technische Weiterentwicklung der Geräte für steigenden Absatz. Nach einer Umfrage, die im Auftrag des Digitalverbands Bitkom durchgeführt wurde, wünschen sich Smartphone-User für ihre Geräte vor allem eine längere Akkulaufzeit (63 % der Befragten), eine Fotokamera mit besserer Qualität (36 %) sowie mehr Speicherkapazität (35 %) und mehr Rechnerleistung (23 %)³. Weitere technische Features, die immer mehr Smartphones aufweisen, sind zum Beispiel ein geschwungener oder biegsamer Bildschirm, ein Fingerabdruck-Sensor oder 3D-Fähigkeit der Kamera. Die Smartphone-Verkäufe 2015 haben gezeigt, dass die Verbraucher bereit sind, in Leistung und Komfort zu investieren. So lag der Durchschnittspreis eines Smartphones 2015 in Deutschland bei 395 €, während im Jahr zuvor durchschnittlich nur 348 € für ein Smartphone ausgegeben wurden.

Die zunehmende Nachfrage nach Smartphones mit komplexen Bauteilen fördert den Umsatz von SÜSS MicroTec bei mehreren Produkten. Unsere Mask Aligner, Belacker und Bonder werden von unseren Kunden eingesetzt, um Chips mit Strukturen zu versehen und um zahlreiche Sensoren, die in jedem Smartphone enthalten sind, herzustellen. Außerdem unterstützt SÜSS MicroTec mit dem UV-Bonden zwei wichtige Prozessschritte, die bei der Herstellung von Optiken auf Wafer-Ebene (Wafer-Level-Optics – WLO) notwendig sind. Nahezu alle Kameras, die in Mobiltelefonen und anderen mobilen Geräten eingebaut sind, bestehen neben dem CMOS-Bildsensor aus einer Optik auf Wafer-Ebene.

Wesentliche Bereiche der globalen Halbleiter-Branche sind auf Asien fokussiert. Dazu gehören einige große Packaging-Häuser (OSATs) sowie viele der weltweit agierenden Hersteller von Speichermedien und MEMS-Bauteilen.

¹ Quelle: Presseinformation des Digitalverbands Bitkom vom 16. Februar 2016

² Quelle: Statista 2016

³ Quelle: Presseinformation des Digitalverbands Bitkom vom 22. Februar 2016

Die starken Marktzyklen der Halbleiter-Industrie bieten SÜSS MicroTec – je nach Art der Entwicklung – zahlreiche neue Chancen im Markt, die kurzfristig für einen starken Anstieg der Auftragseingänge und der Umsätze sorgen können.

Unser globales Netzwerk von Vertriebsmitarbeitern, Produkt-ingenieuren und Handelspartnern ist darauf ausgerichtet, die branchen- und marktspezifischen Anforderungen unserer Kunden weltweit zu erfüllen. SÜSS MicroTec ist in den Kernmärkten der Halbleiter-Equipment-Industrie in Taiwan, China, Japan und Südkorea mit eigenen Tochtergesellschaften vertreten. Unsere Niederlassungen pflegen stets den direkten Kontakt mit unseren Kunden und haben damit die Möglichkeit, aktuelle Entwicklungen auf den Halbleiter-Märkten umgehend zu registrieren. Damit kann SÜSS MicroTec rasch auf sich abzeichnende Neuentwicklungen reagieren und seine Anwendungen entsprechend anpassen.

Um neue Entwicklungen am Markt immer schnell wahrzunehmen, ist uns der direkte und regelmäßige Kontakt zu Kooperationspartnern, Kunden und potenziellen Neukunden sehr wichtig. SÜSS MicroTec ist daher auf Messen für die Halbleiter-Industrie vertreten und veranstaltet internationale Technologie-Foren. So präsentiert SÜSS MicroTec seine Neuentwicklungen regelmäßig auf den Semicon-Messen, die jährlich an verschiedenen Standorten weltweit stattfinden. Daneben präsentiert SÜSS MicroTec seine Entwicklungen auch auf kleineren, lokalen Messen. So fand zum Beispiel im März 2015 parallel zur Semicon China das SÜSS Technology Forum statt, auf dem unseren Kunden in Zusammenarbeit mit verschiedenen Forschungsinstituten Neuheiten präsentiert wurden. In Monterey (Kalifornien, USA) organisierte SÜSS MicroTec zum zweiten Mal das SÜSS Photomask Summit, an dem Manager und Technologen von führenden Masken-Shops, Device-Fabrikanten, Material- und Geräteherstellern sowie wissenschaftlichen Konsortien teilnahmen.

Durch die enge Zusammenarbeit mit SEMI und zahlreichen internationalen Forschungsinstituten kann SÜSS MicroTec einen großen Adressatenkreis ansprechen. Die internationale Präsenz von SÜSS MicroTec und der durch die Messen und Veranstaltungen hohe Bekanntheitsgrad geben uns die Möglichkeit, das Ohr immer direkt am Markt zu haben und auf technologische Fortschritte und Neuentwicklungen schnell zu reagieren.

Operative Chancen

Die Lithografie ist nach wie vor der größte Umsatzbringer der SÜSS MicroTec-Gruppe und sorgt jährlich für etwa zwei Drittel des gesamten Konzernumsatzes. Mit den Produktlinien Mask Aligner und Belacker/Entwickler ist SÜSS MicroTec seit vielen Jahren erfolgreich am Markt vertreten und bedient damit Kunden aus verschiedenen Branchen und Märkten. Das konstante Umsatzvolumen und die relativ stabilen Margen dieser beiden

Produktlinien sichern dem SÜSS MicroTec-Konzern eine gleichmäßige Auslastung der Produktionsstandorte Garching und Sternenfels und beständige positive Cashflows. Mit Weiterentwicklungen und Verbesserungen der Technologien dieser beiden Produktlinien festigen wir unsere Marktposition und stellen sicher, dass mit Mask Alignern und Belackern/Entwicklern auch zukünftig stabile Margen und Cashflows erzielt werden können.

Mit den durch die Akquisition der SÜSS MicroTec Photonic Systems hinzugewonnenen Technologien – der UV-Projektionsbelichtung und der Laserprozessierung – haben wir unser Produktportfolio im Bereich Lithografie ergänzt und erweitert. Im Jahr 2015 konnten wir einen Großauftrag eines führenden Herstellers der Halbleiter-Industrie über eine nennenswerte Stückzahl von Projektionsscannern des Typs DSC300 Gen2 verbuchen. Die Geräte sind für die Serienfertigung im Wachstumssegment Fan-out Wafer-Level Packaging vorgesehen. Die DSC300 Gen2 bietet vergleichbare Fähigkeiten im Hinblick auf Auflösung und Overlay bei gleichzeitig höherem Durchsatz und damit geringere Kosten als herkömmliche Projektionsstepper. Mit dieser erfolgreichen Produkt- und Technologiequalifizierung konnte SÜSS MicroTec seine Führungsposition im Advanced Packaging-Bereich ausbauen. Wenn es uns gelingt, weitere Kunden von unseren Systemen zu überzeugen, könnten wir auch in den kommenden Jahren weiter substanzielle Auftragsvolumina und Umsätze mit Scannern erzielen. Bei entsprechend hohen Stückzahlen könnten zukünftig nachhaltig positive Margen erreicht werden.

Das Segment Substrat Bonder untergliedert sich in die beiden Teilbereiche temporäres und permanentes Bonden. Im Bereich temporäres Bonden konnte die Marktposition im Bereich der TSV-basierten 3D-Speicherchips weiter gefestigt werden, indem wir einen zweiten asiatischen Produktionskunden für einen Teil unserer Gerätelösung gewinnen konnten. Im Bereich permanentes Bonden wurde im Geschäftsjahr 2015 ein neuer halbautomatischer Wafer Bonder entwickelt und in den Markt eingeführt. Das halbautomatische System XB8 kann Wafergrößen bis 200 mm sowie verschiedene Substratgrößen und -typen bearbeiten und basiert auf der Steuerungsplattform des im Jahr 2014 entwickelten SB6/8 Gen2 Wafer Bonders. Durch die umfassenden Neuentwicklungen, die wir im Jahr 2015 durchgeführt haben und auch in den Folgejahren weiter fortsetzen werden, erwarten wir für die Zukunft einen deutlichen Ausbau unserer Marktposition, höhere Umsatzvolumina und langfristig positive Margen.

Im Segment Fotomaschinen Equipment haben wir seit der Akquisition der SÜSS MicroTec Photomask Equipment im Jahr 2010 hohe Umsätze und hohe Margen erzielt. Der Großteil der Umsätze wurde mit wenigen Einzelaufträgen erzielt, die jeweils einen sehr hohen Auftragswert von mehreren Millionen Euro

aufwiesen. Die Umsätze pro Geschäftsjahr weisen daher große Schwankungen auf. In diesem Segment sehen wir unsere Marktposition als sehr gefestigt an und gehen davon aus, auch in Zukunft hohe Gewinne zu erzielen. Wir rechnen jedoch damit, dass sich langfristig weiterhin starke Schwankungen im Umsatz pro Geschäftsjahr ergeben werden, was sich entsprechend auf das Segmentergebnis pro Geschäftsjahr auswirken kann.

Das Geschäft der SÜSS MicroOptics S.A. (Hauterive, Schweiz) hat sich im Jahr 2015 trotz des starken Schweizer Franken sehr positiv entwickelt. Im MicroOptics-Geschäft konnten im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzsteigerungen von knapp 34 % im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet werden. Im Jahr 2015 konnte erstmals der in den gemieteten Räumen neu eingebaute Reinraum vollständig genutzt werden. Durch die neuen Räumlichkeiten konnten bei der Produktion deutliche Effizienzsteigerungen erzielt werden. Dadurch konnten Margenverluste, die sich durch die nachteilige Entwicklung des Kurses des Schweizer Franken ergeben haben, teilweise kompensiert werden. Für die kommenden Jahre erwarten wir weitere Umsatzsteigerungen im MicroOptics-Geschäft und gehen davon aus, dass die SÜSS MicroOptics in Zukunft einen substanziellen Umsatz- und Ergebnisbeitrag zum Konzernergebnis leisten wird.

Finanzielle Chancen

Starke Veränderungen am Währungsmarkt können den Absatz und das Unternehmensergebnis von SÜSS MicroTec sowohl positiv als auch negativ beeinflussen. Der momentan gegenüber dem US-Dollar eher schwach notierende Euro bietet SÜSS MicroTec die Möglichkeit, seine in Deutschland hergestellten Produkte vor allem auf den US-Dollar-dominierten Märkten zu attraktiven Preisen anzubieten. Auch die Wertveränderungen des Euro im Vergleich zum japanischen Yen werden künftig den Absatz und die erzielbaren Margen im asiatischen Raum beeinflussen. Eine Aufwertung des Euro im Vergleich zum japanischen Yen würde sich eher negativ auswirken, während eine Abwertung voraussichtlich positive Effekte für SÜSS MicroTec nach sich ziehen würde.

Der Kurs des japanischen Yen im Vergleich zum Euro unterlag im abgelaufenen Geschäftsjahr starken Schwankungen. Während der japanische Yen zu Jahresbeginn 2015 noch bei 145,04 Yen für einen Euro notierte, lag der Kurs zum 31. Dezember 2015 bei 131,13 Yen pro Euro. In 2016 setzte sich diese Entwicklung fort, sodass der japanische Yen Ende Februar 2016 teilweise deutlich unter 125 Yen pro Euro notierte. Der momentan starke Yen-Kurs könnte die Verkaufszahlen diverser japanischer Wettbewerber, die vor allem im Markt für Belacker aktiv sind, negativ beeinflussen oder bei diesen Wettbewerbern für deutliche Margen einbußen sorgen. Sollte die Stärke des japanischen Yen anhalten

oder der Yen noch weiter aufwerten, sehen wir gute Chancen, Marktanteile von japanischen Wettbewerbern zu gewinnen und Margenverluste, die wir im Wettbewerb mit japanischen Anbietern hinnehmen mussten, wieder zu kompensieren.

Mitarbeiterspezifische Chancen

SÜSS MicroTec sieht sich selbst als mittelständisches Unternehmen, das aufgrund der relativ geringen Unternehmensgröße flache Hierarchien aufweist und so seinen Mitarbeitern in allen Belangen kurze Kommunikationswege und schnelle Entscheidungsprozesse ermöglicht. Unsere mittelständischen Strukturen in Verbindung mit unserer internationalen Ausrichtung machen SÜSS MicroTec zu einem attraktiven Arbeitgeber. Die durchschnittliche Betriebszugehörigkeit unserer weltweit tätigen Mitarbeiter beläuft sich auf beinahe zehn Jahre. Damit zeigen unsere Bemühungen, unseren Mitarbeitern ein gutes Betriebsklima, interessante Aufgaben und eine attraktive Vergütung zu bieten, ihren Erfolg. Wir sind überzeugt, dass wir auch zukünftig alle freien Stellen mit qualifizierten und motivierten Mitarbeitern besetzen können. Unsere bisherige Strategie, langjährige Mitarbeiter zu halten, werden wir unverändert fortsetzen.

Unser Vergütungs-System beinhaltet für unsere Führungskräfte eine variable Vergütung, deren Höhe sich nach dem Grad der Zielerreichung richtet. Die Ziele werden jährlich neu definiert und basieren auf bestimmten Kenngrößen des Konzerns (wie zum Beispiel EBITDA, Umsatz und Auftragseingang), die anhand der aktuellen Budgetplanung jährlich neu festgelegt werden. Zusätzlich werden mit dem Mitarbeiter persönliche Ziele vereinbart. Für die Mitarbeiter des Vertriebs werden in der Regel Ziele definiert, die im Zusammenhang mit der Gewinnung von Kundenaufträgen stehen. Die persönlichen Ziele von Mitarbeitern anderer Abteilungen haben meist Leistungen oder Projekte zum Inhalt, die einen Zusatznutzen für den jeweiligen Fachbereich mit sich bringen. Durch die Einbindung der Budgetplanung in das Vergütungs-System setzen wir für unsere Führungskräfte einen finanziellen Anreiz, aktiv dazu beizutragen, die gesetzten Ziele zu erreichen. Damit erhöhen wir unsere Chancen, unseren geplanten Umsatz und unser geplantes Ergebnis tatsächlich zu erzielen. Die Definition von persönlichen Zielen für die Führungskräfte bietet uns darüber hinaus die Chance, zahlreiche Projekte in verschiedenen Bereichen umzusetzen, auch wenn dafür ein Arbeitseinsatz der Mitarbeiter notwendig ist, der über das normale Tagesgeschäft hinausgeht.

Als weltweit erfolgreiches Technologie-Unternehmen ist SÜSS MicroTec darauf angewiesen, dass die Mitarbeiter, die im Bereich Forschung und Entwicklung tätig sind, neue Produktentwicklungen gezielt vorantreiben, um so den Bedürfnissen unserer Kunden Rechnung zu tragen. SÜSS MicroTec setzt hierzu die

entsprechenden Anreize und vergütet Ideen der Mitarbeiter, die in unseren Produkten zum Einsatz kommen, mit einer jährlich auszahlenden Erfindervergütung.

Unsere internationale Präsenz ermöglicht es uns, hochqualifizierte Mitarbeiter weltweit anzuwerben, wenn es aktuelle Entwicklungen erforderlich machen.

Entwicklungsspezifische Chancen

Im abgelaufenen Geschäftsjahr haben wir unsere Entwicklungsaktivitäten deutlich ausgebaut. Vor allem für die Produktlinien Mask Aligner und Belacker/Entwickler sowie für das Segment Fotomasken Equipment haben wir Mitarbeiter eingestellt und Entwicklungsprojekte auch mit Hilfe von externen Dienstleistern und Kooperationspartnern vorangetrieben. Diese Anstrengungen werden wir auch im kommenden Jahr fortsetzen. Unser Ziel ist es, unsere Produktlinien an die neuesten Entwicklungen im Markt anzupassen und neue Kundenanforderungen zu erfüllen. Damit wollen wir unsere Marktposition festigen und weiter ausbauen.

RISIKOMANAGEMENT-SYSTEM

Zur Erkennung und Steuerung von Risiken sowie zur Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen ist das Risikomanagement-System seit langem Bestandteil der Unternehmensführung.

Neben kurzfristigen (operativen) Risiken befasst sich das Risikomanagement bei SÜSS MicroTec auch mit langfristigen (strategischen) Entwicklungen, die sich negativ auf die Geschäftsentwicklung auswirken können. Auf der Grundlage eines chancenorientierten, gleichzeitig aber risikobewussten Managements ist es jedoch nicht unser Ziel, alle potenziellen Risiken grundsätzlich zu vermeiden. Vielmehr streben wir stets ein Optimum aus Risikovermeidung, -reduzierung und kontrollierter Risikoakzeptanz an. Das Bewusstsein für Risiken sollte nicht die Fähigkeit beeinträchtigen, Chancen zu erkennen und zum Wohle des Unternehmens und seiner Aktionäre zu nutzen.

Organisation und Dokumentation des Risikomanagements

Die Organisation des Risikomanagements orientiert sich an der funktionellen und hierarchischen Struktur des Konzerns. Mit der Einführung des Risikomanagement-Systems wurde ein Risikomanagement-Beauftragter ernannt, der alle drei Monate direkt an den Vorstand berichtet.

Extern wird das eingerichtete Risikofrüherkennungs-System durch den Abschlussprüfer im Rahmen der Jahresabschlussprüfung geprüft. Er berichtet darüber an Vorstand und Aufsichtsrat.

Risikoidentifikation

Alle berichtspflichtigen Einheiten des Konzerns veranstalten mindestens einmal jährlich einen Workshop, der neben der Retrospektive vor allem auf zukünftige Entwicklungen eingeht. Außerdem dienen die Workshops dazu, die konzernweit einheitliche Bewertungsmethodik sicherzustellen. Im Rahmen eines strukturierten Prozesses werden vierteljährlich sämtliche identifizierten Risiken mit Hilfe einer intranet-basierten IT-Lösung erfasst und bewertet. Anschließend werden Risikoberichte erstellt, die bekannte Risiken einer kritischen Würdigung unterziehen und neue Themen aufnehmen.

Plötzlich auftretende Risiken werden darüber hinaus unverzüglich an den Risikomanagement-Beauftragten der jeweiligen Einheit gemeldet.

Die Aufbereitung der Informationen erfolgt durch den Risikobeauftragten, der an den Vorstand berichtet. Die Ergebnisse des Gesamtprozesses werden dem Aufsichtsrat mindestens einmal jährlich präsentiert.

Wichtiger Bestandteil zur Risikofrüherkennung ist das Qualitätsmanagement des Konzerns. An den großen Produktionsstandorten liegt eine Zertifizierung nach ISO 9001 vor, die ein zuverlässiges, prozess- und systemorientiertes Qualitätsmanagement bestätigt. Klar strukturierte und eindeutig dokumentierte Prozesse im Rahmen des Qualitätsmanagements sorgen nicht nur für Transparenz, sondern sind mittlerweile bei den meisten Produktionskunden eine Vorbedingung für die erfolgreiche Vermarktung unserer Maschinen.

Risikobewertung

Die Bewertung von Risiken erfolgt zum einen durch die Angabe der maximalen Schadenshöhe, wenn keine Gegenmaßnahmen ergriffen werden. Auf dieser Grundlage wird der Risikowert durch Einbeziehung einer Eintrittswahrscheinlichkeit ermittelt, wobei auch die entsprechenden Gegenmaßnahmen berücksichtigt werden. Die Angabe des Risikowerts bezieht sich jeweils auf den Zeitraum der kommenden zwölf bzw. 24 Monate.

Die identifizierten Risiken werden mit Hilfe einer Risikomatrix in drei verschiedene Risikokategorien eingeordnet, die sowohl die mögliche Schadenshöhe als auch die Eintrittswahrscheinlichkeit berücksichtigen. Risiken ab einer Schadenshöhe von 10 Mio. € – gemessen an der Höhe des Liquiditätsabflusses – werden als „bestandsgefährdend“ angesehen.

Die Kombination von Eintrittswahrscheinlichkeit und Grad der Auswirkung bestimmt, welche Risikokategorien aus Konzernsicht als wesentlich zu betrachten sind. Hierbei wird unterschieden in geringe (grün), mittlere (gelb) und hohe (rot) Risiken.

■ gering ■ mittel ■ hoch

		Eintrittswahrscheinlichkeit				
		sehr gering	gering	mittel	hoch	sehr hoch
		0% bis ≤5%	>5% bis ≤10%	>10% bis ≤25%	>25% bis ≤50%	>50% bis ≤100%
Auswirkung	bestandsgefährdend	> 10 Mio. € bis ≤20 Mio. €				
	schwerwiegend	>2 Mio. € bis ≤10 Mio. €				
	bedeutend	> 500 Tsd. € bis ≤2 Mio. €				
	moderat	>20 Tsd. € bis ≤500 Tsd. €				
	vertretbar	0€ bis ≤20 Tsd. €				

Entsprechend unserer Methode zur Risikobewertung werden nur die hohen Risiken als wesentlich eingestuft.

Risikohandhabung

Je nach Art des Risikos und der Höhe der Bewertung werden abgestuft Maßnahmen der Risikovermeidung bzw. -minderung getroffen. Dabei orientiert sich das Risikomanagement stets an der einleitend erwähnten Maxime eines chancenorientierten Umgangs mit Risiken.

Die Risikoabwendung und Organisation von Gegenmaßnahmen wird subsidiär durchgeführt. Die Risikoverantwortlichen beziehungsweise die Berichtseinheiten sind zur Entwicklung und Umsetzung von Abwehrstrategien gegen erkannte Risiken verpflichtet. Sollten ihre Kompetenzen nicht zur Umsetzung ausreichen, fordern sie Hilfe von höheren Ebenen an.

Aus der weltweiten Tätigkeit in der Hochtechnologie ergeben sich allgemeine und aktuelle Risiken für das Unternehmen. Der Vorstand hat zur Überwachung von Risiken in geeigneter Weise Maßnahmen getroffen, um Entwicklungen, die den Fortbestand der SÜSS MicroTec-Gruppe gefährden, rechtzeitig zu erkennen.

Beschreibung der wesentlichen Merkmale des internen Kontroll- und Risikomanagements im Hinblick auf den Konzernrechnungslegungsprozess gemäß §289 Abs. 5 HGB und §315 Abs. 2 Nr. 5 HGB

Das Risikomanagement-System im Hinblick auf den Konzernrechnungslegungsprozess zielt darauf ab, das Risiko der Falschaussage in der Konzernrechnungslegung sowie in der externen Berichterstattung zu minimieren. Es dient im ersten Schritt der Identifikation und Bewertung, weiterhin der Begrenzung und Überprüfung erkannter Risiken im Konzernrechnungslegungsprozess, die dem Ziel der Regelungskonformität des

Konzernabschlusses entgegenstehen könnten. Das interne Kontroll-System des Rechnungslegungsprozesses soll gewährleisten, dass trotz identifizierter Risiken in der Finanzberichterstattung ein mit hinreichender Sicherheit regelkonformer Konzernabschluss erstellt wird.

Die Angemessenheit des Risikofrüherkennungs-Systems wird im Rahmen der Abschlussprüfung zum Jahresende durch den Abschlussprüfer überprüft. Dabei werden ausgewählte rechnungslegungsbezogene interne Kontrollen untersucht und deren Effektivität beurteilt. Darüber hinaus werden ausgewählte Aspekte der eingesetzten IT-Systeme geprüft.

Die Verantwortung für die Einrichtung und wirksame Unterhaltung angemessener Kontrollen über die Finanzberichterstattung liegt beim Management der SÜSS MicroTec AG, das zu jedem Geschäftsjahresende die Angemessenheit und Wirksamkeit des Kontroll-Systems beurteilt. Zum 31. Dezember 2015 hat das Management die Wirksamkeit der internen Kontrollen über die Finanzberichterstattung festgestellt. Allerdings bestehen bei jedem Kontroll-System gewisse Einschränkungen hinsichtlich seiner Wirksamkeit. Eine absolute Sicherheit kann auch mit angemessenen und funktionsfähigen Systemen nicht gewährleistet werden.

Die SÜSS MicroTec AG nutzt ihr konzernweit gültiges Bilanzierungshandbuch zur einheitlichen Regelung von Bilanzierungsgrundsätzen. Das Bilanzierungshandbuch basiert auf den IFRS-Rechnungslegungsstandards und wird von allen Konzerngesellschaften beim Rechnungslegungsprozess zugrunde gelegt. Durch eindeutige Vorgaben soll der Ermessensspielraum der Mitarbeiter bei Ansatz und Bewertung von Vermögenswerten und Schulden eingeschränkt und somit das Risiko konzernuneinheitlicher Rechnungslegungspraktiken verringert werden. Den

Tochtergesellschaften sind bestimmte Berichtspflichten und -umfänge zwingend vorgegeben. Die Einhaltung der Berichtspflichten und -fristen wird durch die zentralen Abteilungen Finanzen und Controlling überwacht.

Die Buchhaltung der Tochtergesellschaften wird entweder lokal mit eigenen Mitarbeitern oder mit der Unterstützung von externen Buchführungsfirmen oder Steuerberatungsgesellschaften durchgeführt. Dabei werden unterschiedliche EDV-Systeme eingesetzt. Alle deutschen Gesellschaften arbeiten bereits seit 2008 mit SAP. Seit 2010 wird SAP bei der SÜSS MicroTec (Taiwan) Company Ltd., Hsinchu (Taiwan), verwendet. 2011 wurde SAP bei der SÜSS MicroTec, Inc., Sunnyvale (Kalifornien, USA) implementiert. In 2015 wurde die SÜSS MicroTec Photonic Systems Inc. (Kalifornien, USA) an das konzernweite SAP-System angeschlossen; das „Go-Live“ erfolgte zum 1. Mai 2015. Das Reporting an die Konzernzentrale erfolgt mit Hilfe der Managementinformations-Software „INFOR PM Application Studio“. Die Einzelabschlüsse werden über ein zentrales Konsolidierungs-System zusammengeführt. Auf Konzernebene wird innerhalb der Finanzabteilung und des Controllings die Ordnungsmäßigkeit und Verlässlichkeit der von den Tochtergesellschaften vorgelegten Einzelabschlüsse überprüft. Kontrollen im Rahmen des Konsolidierungsprozesses, wie beispielsweise der Schulden- oder der Aufwands- und Ertragskonsolidierung, erfolgen manuell. Eventuelle Mängel werden korrigiert und an die Tochtergesellschaften zurück berichtet. Die eingesetzten Finanz-Systeme sind durch entsprechende Berechtigungskonzepte und Zugangsbeschränkungen vor Missbrauch geschützt. Zugriffsberechtigungen werden regelmäßig überprüft und gegebenenfalls aktualisiert.

RISIKEN DES KONZERNS

Gesamtwirtschaftliche Risiken

SÜSS MicroTec ist weltweit vertreten, weist eine breite Kundenstruktur auf und bietet seinen Kunden sieben unterschiedliche Produktlinien an, die in verschiedenen Branchen und Industriezweigen eingesetzt werden können. Damit ist SÜSS MicroTec grundsätzlich weder von einzelnen Märkten noch von einzelnen Abnehmern abhängig. Konjunkturelle Einbrüche in einer Region oder Branche können somit zumindest teilweise aufgefangen werden. Dank der flexiblen Aufstellung wäre SÜSS MicroTec bei größeren konjunkturellen Verwerfungen in der Lage, unverzüglich auf die Marktgegebenheiten zu reagieren und die Kostenstrukturen in angemessener Zeit anzupassen. Als Instrumente stehen Gleitzeitkonten, der Einsatz von Zeitarbeitskräften sowie Outsourcing-Maßnahmen zur Verfügung. Darüber hinaus besteht die Option, Kurzarbeit zu beantragen. Zudem werden von den Einkaufsabteilungen regelmäßig die Beschaffungsmengen überprüft und angepasst.

Politische Entscheidungen, neue Gesetzgebungen und sonstige Regularien in den Ländern, in denen SÜSS MicroTec tätig ist, können unser Geschäft negativ beeinflussen. Dazu gehören die Steuergesetzgebung in den jeweiligen Ländern, Exportbeschränkungen sowie Verschärfungen in den Bereichen Produkthaftung, Wettbewerbsrecht, Arbeitssicherheit und Patent- und Markenrecht.

SÜSS MicroTec nimmt regelmäßig an öffentlichen Ausschreibungen teil und zählt zum Beispiel Universitäten und staatliche Forschungseinrichtungen weltweit zu seinen Kunden. Die Regelungen für die Teilnahme an öffentlichen Ausschreibungen und die Kriterien für die Vergabe unterscheiden sich je nach Land und können das Gewinnen von öffentlichen Aufträgen und deren Abwicklung deutlich erschweren.

Generell können starke Veränderungen am Währungsmarkt den Absatz und das Unternehmensergebnis von SÜSS MicroTec sowohl positiv als auch negativ beeinflussen. Der momentan im Vergleich zum US-Dollar schwach notierende Euro bietet SÜSS MicroTec die Möglichkeit, seine in Deutschland hergestellten Produkte vor allem auf den US-Dollar-dominierten Märkten zu attraktiven Preisen anzubieten. Auch die Wertveränderungen des Euro im Vergleich zum japanischen Yen werden künftig den Absatz und die erzielbaren Margen im asiatischen Raum beeinflussen. Eine Aufwertung des Euro im Vergleich zum japanischen Yen würde sich eher negativ auswirken, während eine Abwertung voraussichtlich positive Effekte für SÜSS MicroTec nach sich ziehen würde.

Der im Vergleich zum Euro sehr stark notierende Schweizer Franken hat keine spürbaren Auswirkungen auf das Bestellverhalten unserer Kunden in den Segmenten Lithografie, Substrat Bonder und Fotomasken Equipment. Allerdings ist das Geschäft der SÜSS MicroOptics S.A., die in Hauterive, Schweiz angesiedelt ist und Mikrolinsen herstellt, stark vom Wechselkurs des Schweizer Franken beeinflusst. Der starke Schweizer Franken hat 2015 zu spürbaren Margenverlusten der MicroOptics-Produkte geführt. Im abgelaufenen Geschäftsjahr konnten mit dem MicroOptics-Geschäft zwar Umsatzsteigerungen von knapp 34 % im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet werden. Wir gehen jedoch davon aus, dass das Wachstum noch deutlich stärker ausgefallen wäre, wenn sich der Kurs des Schweizer Franken nicht so nachteilig verändert hätte. Der Umsatz- und Ergebnisbeitrag, den die SÜSS MicroOptics zukünftig zum Konzernergebnis leisten wird, hängt wesentlich von der weiteren Entwicklung des Schweizer Franken ab.

Im Jahr 2015 waren starke Schwankungen des Euro gegenüber den meisten asiatischen Währungen zu beobachten. Betroffen hiervon waren der Kurs des Euro gegenüber dem taiwanesischen

Dollar, dem Singapur-Dollar, dem südkoreanischen Won und dem chinesischen Renminbi Yuan. Der SÜSS MicroTec-Konzern wickelt nur in sehr geringem Umfang Geschäfte in diesen Währungen ab. Die in Taiwan, Singapur, Südkorea und China ansässigen Tochtergesellschaften des Konzerns weisen jedoch in Euro dotierte Forderungen gegen Kunden und andere SÜSS MicroTec Gesellschaften aus. Je nach Umfang und Fälligkeit können aus der Bewertung dieser Forderungen in der jeweiligen Landeswährung signifikante Währungsverluste im Konzern entstehen.

Branchen- und marktspezifische Risiken

Die schwierige Einschätzbarkeit der kurz- und mittelfristigen Marktentwicklung gehört unverändert zu den größten Risiken des Unternehmens. Insbesondere die Halbleiter-Industrie, die zu unseren Absatzmärkten zählt, ist von starken Marktzyklen geprägt. Ein starker Einbruch des gesamten Halbleiter-Marktes würde bei SÜSS MicroTec Umsatzrückgänge nach sich ziehen und das Unternehmensergebnis schmälern. Den damit verbundenen Risiken begegnen wir durch schlanke Strukturen, die bei schwacher Geschäftsentwicklung zügig angepasst und gegebenenfalls durch Outsourcing ergänzt werden können.

Mitarberspezifische Risiken

In einzelnen Bereichen ist das Unternehmen von dem Wissen einzelner Mitarbeiter abhängig, vor allem im Bereich der Forschung und Entwicklung. Eine Nichtverfügbarkeit dieser Mitarbeiter für die Gruppe stellt ein entsprechendes Risiko dar, das durch interne Dokumentationspflichten kontrolliert wird.

Entwicklungsspezifische Risiken

Das Geschäftsmodell der SÜSS MicroTec-Gruppe basiert auf seiner starken Innovationskultur und Technologieführerschaft. Als Hersteller von Spezialmaschinen liefert SÜSS MicroTec kundenspezifische Lösungen und richtet seine Produktpolitik nach den sich schnell verändernden Bedingungen im Halbleiter-Equipment-Markt. Trotzdem sehen wir das Risiko, dass in Einzelfällen unsere technischen Entwicklungen die Vorstellungen der Märkte und unserer Kunden verfehlen könnten. In diesen Fällen bestünde die Gefahr, dass sich die betroffenen Kunden von SÜSS MicroTec abwenden und alternative technische Lösungen bei unseren Konkurrenten suchen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr haben sich unsere Ingenieure verstärkt um dieses Thema gekümmert und intensiv die Märkte und Kundenwünsche analysiert. Einige Neuentwicklungen, die auf spezielle Kundenwünsche eingehen, wurden auf den Markt gebracht und von unseren Kunden sehr gut angenommen. Damit sehen wir die Eintrittswahrscheinlichkeit für das beschriebene Risiko als deutlich geringer an.

Neben der Ausarbeitung von kundenspezifischen Lösungen arbeiten die Ingenieure der SÜSS MicroTec-Gruppe permanent an langfristigen Entwicklungsprojekten, die zukünftige Entwicklungen der Märkte antizipieren sollen, damit die Produkte von SÜSS MicroTec auch in Zukunft aktuelle technische Anforderungen erfüllen werden. Es besteht das Risiko, dass einzelne Entwicklungsprojekte nicht zum gewünschten Ergebnis führen oder das erzielte Ergebnis nicht die Erwartungen der Märkte trifft. In diesen Fällen bestünde die Gefahr, dass SÜSS MicroTec auf dem angestrebten Markt zeitweise kein innovatives Produkt anbieten kann. Die betroffenen Kunden könnten sich von SÜSS MicroTec abwenden und Alternativen am Markt suchen. Zudem hätte SÜSS MicroTec knappe Ressourcen im Bereich Entwicklung ungünstig eingesetzt. Im abgelaufenen Geschäftsjahr haben wir uns verstärkt auf diese Problematik konzentriert und die Zusammenarbeit zwischen unseren Ingenieuren und den asiatischen Vertriebsgesellschaften intensiviert, um besser auf die Vorstellungen unserer Kunden und potenziellen Kunden einzugehen. Damit konnten wir einige Erfolge erzielen und werden diese Form der Zusammenarbeit auch in Zukunft fortsetzen. Das beschriebene Risiko sehen wir nun als deutlich geringer an.

Für einige unserer Produkte sehen wir uns als Marktführer, da wir mit technologisch hochwertigen Lösungen die Anforderungen unserer Kunden passgenau erfüllen. Um diese Marktführerschaft und die Zufriedenheit unserer Kunden zu erhalten, sind laufend Neuentwicklungen und Verbesserungen an unseren bestehenden Produkten erforderlich (zum Beispiel um den weiteren Verkleinerungen der Strukturen in der Halbleiter-Industrie Rechnung zu tragen). Es besteht das Risiko, dass technische Neuentwicklungen von uns nicht rechtzeitig erkannt oder umgesetzt werden. In diesen Fällen sehen wir die Gefahr, dass SÜSS MicroTec seine Marktführerschaft in einzelnen Bereichen verlieren könnte und auf lange Sicht Umsatzeinbußen hinnehmen müsste.

Operative Risiken

Angesichts des hohen Bestands an flüssigen Mitteln, der hohen Eigenkapitalquote und der schlanken Kostenstruktur sind die Risiken, die sich für SÜSS MicroTec aus der aktuellen Vermögens- und Ertragslage ergeben könnten, begrenzt. Mit einem EBIT von 5,0 Mio. € hat der SÜSS MicroTec-Konzern 2015 zudem ein deutlich positives Ergebnis erzielt. Unter Berücksichtigung des zum Jahresende 2015 vorhandenen Auftragsbestands und der erwarteten Auftragseingangsentwicklung für das erste Halbjahr 2016 gehen wir davon aus, 2016 einen Umsatz in der Bandbreite zwischen 170 Mio. € und 180 Mio. € und ein positives EBIT zwischen 9 und 13 Mio. € zu erzielen.

Zum 31. Dezember 2015 weist SÜSS MicroTec einen Goodwill in Höhe von rund 15,8 Mio. € aus, der ausschließlich dem Segment Lithografie zuzuordnen ist. Das Segment Lithografie

erwirtschaftet mehr als die Hälfte des Konzernumsatzes und ein positives Segmentergebnis. Das Segment Lithografie wird auch im nächsten Jahr mehr als die Hälfte des gesamten Konzernumsatzes erwirtschaften und wird weiterhin profitabel sein. Für Wertminderungen im Segment Lithografie sehen wir daher keine Anzeichen.

Die Produktlinie Mask Aligner, die zum Segment Lithografie gehört, ist eine der umsatzstarken Produktlinien der SÜSS MicroTec-Gruppe und leistet seit vielen Jahren einen hohen Ergebnisbeitrag zum Konzernergebnis. Wir gehen fest davon aus, dass diese Produktlinie auch in den kommenden Jahren einen hohen Umsatzbeitrag und stabile Margen erzielen wird. Trotzdem besteht das Risiko, dass der Mask Aligner zukünftig die technischen Anforderungen der Kunden nicht mehr erfüllen kann und von anderen Technologien verdrängt werden könnte. Dieses Risiko sehen wir jedoch als gering an. Zudem kann SÜSS MicroTec seinen Kunden mit den in den USA angesiedelten Produktlinien, den Laser- und Scanner-Systemen, alternative Lösungen anbieten.

Auch die Produktlinie Belacker, die ebenfalls zum Segment Lithografie gehört, leistet seit vielen Jahren einen hohen Umsatz- und Ergebnisbeitrag zum Konzernergebnis. Seit Mitte 2013 nehmen wir zunehmend chinesische Wettbewerber wahr, die am Markt Kundenaufträge vor allem für technisch weniger anspruchsvolle Tools gewinnen konnten. Auch bringen japanische Hersteller, die teilweise bisher nur am Frontend-Markt tätig waren, verstärkt 300-mm-Systeme auf den Midend- / Backend-Markt und bieten den Kunden technologisch gute Lösungen an. In China mussten wir durch diese Entwicklung bereits Umsatzeinbußen hinnehmen. Es besteht das Risiko, dass sich diese Entwicklung fortsetzt und sowohl die japanischen als auch die chinesischen Hersteller zukünftig auch die technologisch anspruchsvollen Geräte, an denen SÜSS MicroTec bisher einen hohen Marktanteil hat, erfolgreich am Markt anbieten. Sollte dieses Szenario eintreten, müssten wir unsere Preise für die angebotenen Maschinen reduzieren, was Umsatz- und Margeneinbußen zur Folge hätte. Es ist nicht auszuschließen, dass wir trotz dieser Maßnahmen Marktanteile verlieren, wenn die konkurrierenden Hersteller aus Asien auf diesem Markt weiter Fuß fassen.

Im Segment Lithografie sind auch die Produktlinien der SÜSS MicroTec Photonic Systems für UV-Projektionsbelichtung und Laserprozessierung erfasst. Im abgelaufenen Geschäftsjahr wiesen diese Produktlinien ein negatives Ergebnis auf. Im Jahr 2015 konnten wir einen Großauftrag eines führenden Herstellers für Halbleiter-Industrie über eine nennenswerte Stückzahl von Projektionsscannern des Typs DSC300 Gen2 verbuchen. Mit dieser erfolgreichen Produkt- und Technologiequalifizierung konnte SÜSS MicroTec seine Führungsposition im Advanced

Packaging-Bereich weiter ausbauen. Der größte Teil des Umsatzes für diesen Auftrag wird 2016 realisiert werden. Aufgrund der technischen Spezifikation der bestellten Geräte und den damit verbundenen umfangreichen Entwicklungsleistungen rechnen wir für diesen Großauftrag mit einer geringen Marge. Demzufolge werden die Produktlinien der SÜSS MicroTec Photonic Systems insgesamt auch 2016 ein negatives Ergebnis erzielen. Ein positiver Ergebnisbeitrag kann mit den Photonic Systems-Produktlinien nur erzielt werden, wenn es uns gelingt, weitere Kunden von unseren Systemen zu überzeugen und damit weitere substanzielle Auftragsvolumina und Umsätze zu erzielen. Sollte es SÜSS MicroTec nicht gelingen, mit den Laser- und Scanner-Systemen substanzielle Umsätze und positive Margen zu erzielen, würden dadurch das Ergebnis des Segments Lithografie und das Konzernergebnis weiterhin negativ beeinflusst werden. Zudem könnte sich im Einzelabschluss der SÜSS MicroTec AG zusätzlicher Wertberichtigungsbedarf auf die Ausleihungen an die SÜSS MicroTec Photonic Systems Inc. ergeben, sofern die in den USA gefertigten Produktlinien dauerhaft ein negatives Ergebnis erzielen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr war das Segment Substrat Bonder erneut defizitär und erzielte ein Segment-EBIT von -4,0 Mio. €. Wir gehen davon aus, dass das Segment Substrat Bonder auch im kommenden Jahr ein negatives Ergebnis erzielen wird. SÜSS MicroTec hat allerdings seine Aktivitäten im Bereich Forschung und Entwicklung im abgelaufenen Geschäftsjahr nochmals deutlich verstärkt. Im Bereich permanentes Bonden wurde 2015 ein neuer halbautomatischer Wafer Bonder entwickelt und in den Markt eingeführt. Das halbautomatische System XB8 kann Wafergrößen bis 200 mm sowie verschiedene Substratgrößen und -typen bearbeiten und basiert auf der Steuerungsplattform des im Jahr 2014 entwickelten SB6/8 Gen2 Wafer Bonders. Weitere Produktinnovationen sind geplant. Wir gehen davon aus, dass wir mit diesen und weiteren Maßnahmen verlorene Marktanteile im Markt für permanentes Bonden wieder zurückgewinnen und unsere Marktposition ausbauen können. Trotzdem besteht das Risiko, dass wir auf dem Markt für permanentes Bonden die erforderlichen Stückzahlen nicht werden erreichen können. In diesem Fall würden die permanenten Bonder auch in Zukunft einen negativen Ergebnisbeitrag zum Segmentergebnis liefern. Zudem könnten davon auch andere Produktlinien negativ beeinflusst werden. So erwarten vor allem Forschungsinstitute und Universitäten, aber auch Kunden im Bereich MEMS, dass sie Mask Aligner, Belacker/Entwickler und Permanent Bonder von einem Anbieter beziehen können. Sollte es uns nicht gelingen unsere permanenten Bond-Systeme nachhaltig am Markt zu etablieren, wären auch bei den Produktlinien Belacker/Entwickler und Mask Aligner Umsatzeinbußen denkbar.

Auch im Bereich temporäres Bonden konnten wir im Jahr 2015 wichtige Meilensteine auf dem Weg zur Volumenproduktion erreichen. Im Bereich der TSV-basierten 3D-Speicherchips konnten wir unsere Marktposition festigen, indem wir einen zweiten asiatischen Produktions-Kunden für einen Teil unserer Geräte-lösung gewinnen konnten. Generell wird die 3D-Integration für die Volumenproduktion bei unseren Kunden noch nicht eingesetzt. Zudem besteht das Risiko, dass sich am Markt andere Technologien und Prozesse durchsetzen werden als die, die von SÜSS MicroTec entwickelt und angeboten werden. Der Erfolg unserer Technologie des Temporary Bonding und Debonding hängt entscheidend davon ab, ob sich die von uns entwickelten Technologien und Prozesse am Markt durchsetzen und ob sich die 3D-Integration in der industriellen Fertigung für die Volumenproduktion etablieren wird. Nur durch den Verkauf hoher Stückzahlen werden wir zukünftig im Segment Substrat Bonder unsere Margen verbessern und nachhaltig positive Ergebnisse erzielen können.

Im jetzigen Marktumfeld besteht unverändert ein deutlicher Preisdruck. Dieser beinhaltet das Risiko, dass auch bei sich erholenden Märkten ursprüngliche Zielverkaufspreise nicht mehr erzielt werden können. Diesem Risiko begegnen wir mit einer stetigen Preispolitik. So verzichten wir bei unattraktiven Konditionen auch auf Aufträge, um bei sich erholenden Märkten den Kunden gegenüber eine konsistente Preisgestaltung zu gewährleisten.

Die Produkte von SÜSS MicroTec werden durch ein umfassendes Risiko- und Qualitätsmanagement regelmäßig analysiert, kontrolliert und optimiert. Aufgrund des Einsatzes der Produkte im Produktionsumfeld von Unternehmen mit wachsenden Anforderungen an die Produktqualität kann sich das Haftungsrisiko für SÜSS MicroTec erhöhen. SÜSS MicroTec verfügt, neben anderen Versicherungen, über eine Produkthaftpflichtversicherung für die Gruppe, die das potenzielle Risiko soweit möglich limitiert. Die Angemessenheit dieser Versicherungen, in deren Schutz auch die Konzerngesellschaften einbezogen sind, wird regelmäßig hinsichtlich der abgedeckten Risiken und Deckungssummen überprüft und bei Bedarf angepasst. Darüber hinaus bemühen wir uns, mit allen Vertragspartnern Haftungsbeschränkungen in den Verträgen zu vereinbaren.

Risiken der Informationstechnologie

Grundsätzlich sehen wir unsere IT-Infrastruktur als gut ausgebaut an und sind der Meinung, dass wir ausreichend Vorkehrungen getroffen haben, um Datenmanipulationen, Datenverluste oder Datenmissbrauch zu vermeiden. Zudem investieren wir regelmäßig in neue Hard- und Software, um den Ausfall von IT-Systemen und Software-Lösungen möglichst gering zu halten. Mit Virenschaltern und Viren-Schutzprogrammen, die laufend auf dem aktuellen Stand gehalten werden, schützen wir unsere

IT-Systeme vor Zugriffen und Beschädigungen von außen. Trotzdem können wir nicht ausschließen, dass es in einzelnen Fällen zu Datenmanipulationen, Datenverlusten oder Datenmissbrauch kommen könnte. Es ist auch denkbar, dass neue Viren oder Trojaner, die von unseren Sicherheitsprogrammen nicht erkannt werden, in unsere IT-Systeme eindringen könnten. Verschärft wird das Problem durch die zunehmende Nutzung von mobilen Endgeräten wie Notebooks oder Smartphones, die auf unser Firmennetzwerk zugreifen. Um das Risiko fremder Zugriffe auf unser Firmennetzwerk, das sich durch die Nutzung von mobilen Endgeräten ergibt, möglichst gering zu halten, ist eine konzernweit geltende Richtlinie in Kraft, die den Umgang mit mobilen Endgeräten regelt.

Finanzielle Risiken

KREDITRISIKEN

Ein Kreditrisiko ist der unerwartete Verlust an Zahlungsmitteln oder Erträgen. Dieser tritt ein, wenn der Kunde nicht in der Lage ist, seinen Verpflichtungen innerhalb der Fälligkeit nachzukommen, oder die als Sicherheit dienenden Vermögenswerte an Wert verlieren. Das Unternehmen hat eine konzernweit gültige Richtlinie zum Thema „Credit Assessment“ implementiert. Diese Richtlinie legt für die einzelnen Vertriebsseinheiten des Unternehmens fest, welche Zahlungsbedingungen und Zahlungsabsicherungen im Einzelfall unter Berücksichtigung kunden- und länderspezifischer Aspekte vereinbart werden. Aufträge mit Kunden, die in sogenannten Risk Countries angesiedelt sind, können demzufolge nur gegen Anzahlung des gesamten Auftragswertes, einer Bankgarantie oder eines Letter of Credit abgewickelt werden. Im Fall von Kunden, die in sogenannten Non Risk Countries ansässig sind und eine bestimmte Größenordnung überschreiten, wird ein entsprechendes Kundenrating erstellt. Die Ratings beruhen auf den Angaben externer Kreditratingagenturen. Je nach Einstufung des Kunden sind für die Auftragsabwicklung abgestufte Zahlungskonditionen bzw. -absicherungen notwendig.

Vom Bruttobestand der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 13,6 Mio. € (Vorjahr: 13,7 Mio. €) sind zum Bilanzstichtag insgesamt 9,1 Mio. € (Vorjahr: 9,5 Mio. €) der Forderungen weder überfällig noch wertgemindert. Bei diesen Forderungen lagen zum 31. Dezember 2015 keine Anhaltspunkte vor, dass Zahlungsausfälle eintreten werden.

Die Altersstruktur der überfälligen, aber nicht wertgeminderten Forderungen stellt sich zum Bilanzstichtag und zum Vorjahresstichtag wie folgt dar:

in Tsd. €	2015	2014
Altersanalyse der überfälligen Forderungen ohne Wertberichtigung		
1–30 Tage	2.394	2.448
31–60 Tage	1.040	546
61–90 Tage	215	626
91–180 Tage	0	116
Überfällige Forderungen ohne Wertberichtigung	3.649	3.736

Insgesamt sind zum Bilanzstichtag 0,8 Mio. € (Vorjahr: 0,5 Mio. €) des Bruttoforderungsbestands überfällig und wertberichtigt.

Die Altersstruktur der überfälligen und wertberichtigten Forderungen zum Bilanzstichtag und zum Vorjahresstichtag ist in folgender Tabelle dargestellt:

in Tsd. €	2015	2014
Altersanalyse der überfälligen Forderungen mit Wertberichtigungen		
< 91 Tage	21	0
91–180 Tage	527	179
181–360 Tage	76	36
> 360 Tage	174	250
Überfällige Forderungen mit Wertberichtigung	798	465

Weitere Informationen zur Bestimmung von Wertberichtigungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen finden sich im Konzernanhang.

LIQUIDITÄTSRISIKEN

Zum Jahresende weist der SÜSS MicroTec-Konzern einen Net Cash-Bestand von 40,0 Mio. € aus (Vorjahr: 38,0 Mio. €). Der Free Cashflow (bereinigt um Effekte aus Wertpapiererwerben und Wertpapierverkäufen) belief sich im abgelaufenen Geschäftsjahr auf 1,3 Mio. € (Vorjahr: 2,1 Mio. €).

Zwischen der SÜSS MicroTec AG und der IKB Deutsche Industriebank AG besteht ein Darlehensvertrag, der der Finanzierung des Betriebsgrundstücks in Garching dient. Das Darlehen belief sich ursprünglich auf 7,5 Mio. €. Es wurde am 16. Dezember 2013 valutiert und zur Auszahlung gebracht und weist eine Laufzeit bis zum 30. Juni 2021 auf. Ein weiterer Darlehensvertrag besteht zwischen der SÜSS MicroTec AG und einer lokalen Volksbank und dient der Finanzierung des Betriebsgrundstücks in Sternenfels. Dieses Darlehen belief sich ursprünglich

auf 4,5 Mio. €. Es wurde am 6. Juli 2010 valutiert und zur Auszahlung gebracht und hat eine Laufzeit bis zum 30. Juni 2020. Zum 31. Dezember 2015 weist der SÜSS MicroTec-Konzern für diese beiden Darlehen Bankverbindlichkeiten von 9,1 Mio. € aus. Die jährliche Tilgung für die beiden Darlehen wird sich für die kommenden Jahre auf 1,2 Mio. € pro Jahr belaufen. Zudem fallen für die beiden Darlehen bankübliche Zinsen an.

Dem SÜSS MicroTec-Konzern stehen insgesamt Kredit- und Avallinien von 9,0 Mio. € bei nationalen und internationalen Bankinstituten und Versicherungen zur Verfügung. Drei Banken stellen der SÜSS MicroTec Lithography GmbH im Rahmen eines Bankenkonsortiums Kredit- und Avallinien von insgesamt 4,5 Mio. €. Diese Kredit- und Avallinien werden bis auf weiteres gewährt. Eine Bank des Konsortiums hat der SÜSS MicroTec Lithography GmbH darüber hinaus eine zusätzliche Avallinie über 1,0 Mio. € gewährt, die bis zum 30. April 2016 befristet ist. Eine weitere Kreditlinie in Höhe von 1,0 Mio. € steht der SÜSS MicroTec Photomask Equipment GmbH & Co. KG zur Verfügung. Darüber hinaus besteht im Rahmen eines Kautionsversicherungsvertrages ein weiterer Bürgschaftsrahmen in Höhe von 2,5 Mio. €, der von der SÜSS MicroTec Lithography GmbH und der SÜSS MicroTec REMAN GmbH genutzt werden kann. Diese Kredit- und Avallinien nutzen wir derzeit, um Anzahlungsbürgschaften im operativen Geschäft zu stellen. Zum 31. Dezember 2015 sind diese Kredit- und Avallinien in Höhe von 5,4 Mio. € in Form von Avalen in Anspruch genommen. Wir gehen fest davon aus, dass wir auch zukünftig alle erforderlichen Anzahlungsbürgschaften stellen können.

Die Minimierung der Abhängigkeit, insbesondere von kurzfristigem Fremdkapital, soll ein potenzielles Finanzierungsrisiko gering halten. Wir begegnen diesem Risiko vor allem durch das Ziel, mit entsprechenden Cashflows auch aus der Optimierung des Working Capital den Anteil des Fremdkapitals auf niedrigem Niveau zu halten. Weitere Einzelheiten zur Liquiditätssituation der Gesellschaft finden sich unter Textziffer (25) des Konzernanhangs.

MARKTPREISRISIKEN

Marktpreisschwankungen können für das Unternehmen signifikante Cashflow- sowie Gewinnrisiken zur Folge haben. Änderungen der Fremdwährungskurse und der Zinssätze beeinflussen sowohl das weltweite operative Geschäft als auch die Investitions- und Finanzierungsalternativen.

SÜSS MicroTec ist im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit aufgrund der internationalen Ausrichtung Fremdwährungsrisiken ausgesetzt. Die Währungssicherung erfolgt auf Basis bestehender Fremdwährungsaufträge. Für Aufträge, die binnen drei bzw. sechs Monaten abgearbeitet werden, beträgt die Sicherungsquote rund 65 % bzw. 45 %. Gegenläufige Zahlungsströme,

die sich insbesondere aus Fremdwährungsbestellungen von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen ergeben, werden von dem so ermittelten zu sichernden Fremdwährungsbetrag abgesetzt. Als Sicherungsinstrumente werden Devisentermingeschäfte genutzt. Für weitere Einzelheiten verweisen wir auf den Konzernanhang unter Textziffer (30).

Eine günstige Entwicklung der Fremdwährungskurse kann zu höheren Margen einzelner Aufträge führen und zusätzliche Kursgewinne generieren.

Das Zinsänderungsrisiko des Unternehmens ist begrenzt, da auf das variabel verzinsten Darlehen im Zusammenhang mit der Grundstücksfinanzierung Sternenfels ein laufzeitkongruenter Zinsswap gelegt wurde. Ursprünglich variable Konditionen

wurden dadurch in fixe Konditionen eingetauscht. Das Darlehen im Zusammenhang mit der Grundstücksfinanzierung Garching ist mit einem fixen Zinssatz belegt.

GESAMTEINSCHÄTZUNG

Im Konzern wurden im Geschäftsjahr 2015 keine bestandsgefährdenden Risiken identifiziert. Der Fortbestand des Unternehmens war unter Substanz- und Liquiditätsgesichtspunkten zu keiner Zeit gefährdet.

Die für den SÜSS MicroTec-Konzern wesentlichen Risiken sind in der folgenden Tabelle im Überblick dargestellt. Die Risiken wurden dabei nach der Eintrittswahrscheinlichkeit sowie nach den möglichen finanziellen Auswirkungen (gemessen an der Höhe des möglichen Liquiditätsabflusses) bewertet.

	Eintrittswahrscheinlichkeit					Auswirkung				
	<i>sehr gering</i>	<i>gering</i>	<i>mittel</i>	<i>hoch</i>	<i>sehr hoch</i>	<i>vertretbar</i>	<i>moderat</i>	<i>bedeutend</i>	<i>schwerwiegend</i>	<i>bestandsgefährdend</i>
	0 % bis ≤5 %	>5 % bis ≤10 %	>10 % bis ≤25 %	>25 % bis ≤50 %	>50 % bis ≤100 %	0 € bis ≤20 Tsd. €	>20 Tsd. € bis ≤500 Tsd. €	>500 Tsd. € bis ≤2 Mio. €	>2 Mio. € bis ≤10 Mio. €	>10 Mio. € bis ≤20 Mio. €
Gesamtwirtschaftliche Risiken										
Negative Auswirkungen durch Wechselkurs-schwankungen			X					X		
Entwicklungsspezifische Risiken										
Produktpolitik, Kundenzufriedenheit ¹			X						X	
Ungenügende Innovationsfähigkeit, verfehlte Entwicklungsprojekte ¹			X						X	
Verlust der Marktführerschaft in einzelnen Bereichen			X						X	
Operative Risiken										
Umsatzeinbußen bei Mask Alignern	X							X		
Verlust von Marktanteilen für Belacker				X					X	
Keine Profitabilität von UV-Projektionsbelichtung und Laserprozessierung			X					X		
Permanentes Bonden – Marktanteil kann nicht ausgebaut werden			X					X		
Temporäres Bonden – die von SÜSS MicroTec entwickelte Technologie setzt sich am Markt nicht durch			X					X		
Produkthaftung	X							X		
IT-Risiken										
Datensicherheit			X				X			

¹ Eintrittswahrscheinlichkeit Vorjahr: hoch

Prognosebericht

Das Geschäftsumfeld von SÜSS MicroTec wird durch die regionalen wie auch die weltweiten konjunkturellen Bedingungen sowie Branchenentwicklungen beeinflusst. In dem nachfolgenden Prognosebericht gehen wir auf die verschiedenen Faktoren ein, die das Unternehmen ebenso wie führende Markt- und Branchenbeobachter als maßgeblich für die weitere Geschäftsentwicklung ansehen.

Gemäß den Schätzungen des ifo Instituts München, wird sich das Weltwirtschaftsklima in den kommenden Monaten spürbar abkühlen. So lag der Indikator des ifo Index für die Weltwirtschaft im vierten Quartal 2015 nur noch bei 89,6 Punkten und damit deutlich unter dem Vorquartalswert von 95,9 Punkten sowie unter dem langfristigen Durchschnitt von 96,1 Punkten. Dabei hat sich die Einschätzung der aktuellen Lage nur wenig verschlechtert, allerdings ist der Ausblick weniger positiv als im Vorquartal. Insgesamt verschlechterte sich das Weltwirtschaftsklima in nahezu allen Regionen. In Europa und Nordamerika liegt der Indikator trotz der Eintrübung über seinem langfristigen Durchschnitt, in Asien, Lateinamerika, im Nahen Osten und Afrika jedoch deutlich darunter. Das Klima in Europa, Nordamerika und Lateinamerika trübte sich vor allem aufgrund der weniger positiven Konjunkturerwartungen ein. Dagegen waren in Asien, im Nahen Osten und Afrika beide Klimakomponenten, Lage und Erwartung, für die Verschlechterung ausschlaggebend. Insbesondere die anhaltende Schwächephase der chinesischen Wirtschaft belastet die globale Konjunktur und deren Ausblick. Gemäß den Schätzungen der OECD vom 18. Februar 2016 betrug das globale Wirtschaftswachstum 3,0% im Jahr 2015 und wird 2016 erneut um 3,0% wachsen.

Die gesamte Europäische Union sowie die Eurozone werden gemäß der Erwartungen der Europäischen Kommission auch im Wirtschaftsjahr 2016 erneut leicht positive Wachstumsraten aufweisen. Die OECD erwartet für die Eurozone für 2015 und 2016 jeweils ein Wachstum von 1,5% bzw. 1,4%. Für die Europäische Union insgesamt geht man im gleichen Zeitraum von einem leicht höheren Plus von zunächst 1,9% und im Jahr 2016 von einer Zunahme des realen Bruttoinlandsprodukts um 2,0% aus. Getragen wird das Wachstum durch starke Exporte, die dem vergleichsweise schwachen Euro geschuldet sind, sowie dem niedrigen Ölpreis und dem dadurch gestiegenen zur Verfügung stehenden Einkommen.

Im Dezember-Monatsbericht der Deutschen Bundesbank ist zu lesen, dass die deutsche Wirtschaft im Geschäftsjahr 2015 überwiegend durch die lebhaftere Binnennachfrage getragen wurde. In den neuesten Schätzungen der OECD geht man von einem leicht verlangsamten Wirtschaftswachstum in Deutschland für 2016 aus, die Zuwachsrate wird voraussichtlich bei 1,3% nach 1,4% im Jahr 2015 liegen.

Branchenspezifische Rahmenbedingungen

HALBLEITER-INDUSTRIE

Das Marktforschungsinstitut Gartner hat am 7. Januar 2016 in einer Pressemeldung seine aktuellen Erwartungen für die Entwicklung des gesamten Halbleiter-Marktes veröffentlicht. War man noch im April bzw. Juli 2015 von einem Wachstum des Halbleiter-Marktes um 4,0 bzw. 2,2% ausgegangen, so wird laut den aktuellsten Schätzungen sogar ein leichter Rückgang in der Branche um 1,9% gegenüber Vorjahr erwartet. Im Geschäftsjahr 2015 lag das Marktvolumen somit bei 333,7 Mrd. USD nach 340,3 Mrd. USD im Vorjahr. Die Gründe hierfür sind im Wesentlichen die erneut reduzierten Absatzprognosen für Smartphones, Tablets und PCs sowie der anhaltend starke US-Dollar, welcher die Nachfrage nach Elektronikprodukten außerhalb der USA dämpft. Für das Geschäftsjahr 2016 ist man wieder optimistischer und erwartet, dass der Halbleiter-Markt erneut wachsen und ein Gesamtvolumen von 344,1 Mrd. USD erreichen wird (Gartner Oktober 2015).

Wie sich in den vergangenen Jahren gezeigt hat, ist die Prognosegenauigkeit aufgrund der Besonderheiten und der ausgeprägten Zyklizität im Halbleiterbereich sehr begrenzt: so unterscheiden sich einige Schätzungen der Marktforschungsinstitute auch zum Jahresende 2015 deutlich von den eigenen Schätzungen im Vergleich zum Jahresanfang. Vor diesem Hintergrund stellen die nun folgenden Ausführungen Einschätzungen dar, die auf Basis der

zum derzeitigen Zeitpunkt zur Verfügung stehenden Informationen getroffen wurden, aber keine Garantie für das tatsächliche Eintreten der Prognosen bieten.

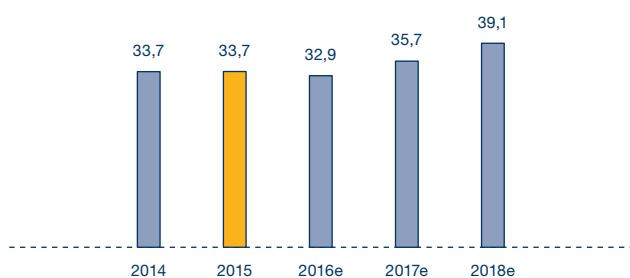
HALBLEITER-EQUIPMENT-INDUSTRIE

Der gesamte Halbleiter-Equipment-Markt hat sich in den Jahren 2010 bis 2015 extrem volatil gezeigt, positive Wachstumsraten von rund 9 % im Jahr 2011 waren gefolgt von deutlichen Rückgängen um 15 % bzw. 14 % in den Jahren 2012 und 2013, um dann im Jahr 2014 wieder ein Wachstum von rund 18 % auszuweisen. Für 2015 geht Semi von einem leichten Rückgang um 0,6 % aus. Auch der Ausblick für 2016 ist eher moderat, so erwartet man für das laufende Jahr ein Wachstum im Halbleiter-Equipment-Bereich um moderate 1,4 %. Damit dürfte der Halbleiter-Equipment-Markt im Jahr 2016 auf ein Volumen von rund 37,8 Mrd. USD wachsen, 2015 waren es entsprechend 37,3 Mrd. USD.

Nach Aussage des Branchenverbands Semi wurde 2015 überwiegend in Maschinen für die Herstellung von Speicherchips, insbesondere für DRAMs mit einer Strukturgröße von 21/20 nm, investiert. Dieser Trend wird sich 2016 deutlich abschwächen, denn im laufenden Geschäftsjahr werden zunehmend Investitionen für Flash-Speichermedien unterstellt.

Für das Backend der Halbleiter-Industrie, dem Hauptabsatzmarkt für SÜSS MicroTec-Maschinen, erwartet Gartner für 2016 in seinen Schätzungen vom 11. Januar 2016 einen leichten Rückgang des Equipment-Marktvolumens im Bereich Wafer-Level Packaging und Assembly um rund 0,1 % gegenüber 2015 (Vorjahr plus 4,4 %). Auch für diese Prognosen gilt die Aussage, dass die Erwartungen der Marktforschungsinstitute sich im Zeitablauf häufig deutlich verändern und gesicherte Prognosen nicht möglich sind.

Markt für Wafer-Level Manufacturing Equipment in Mrd. USD



Quelle: Gartner, Januar 2016

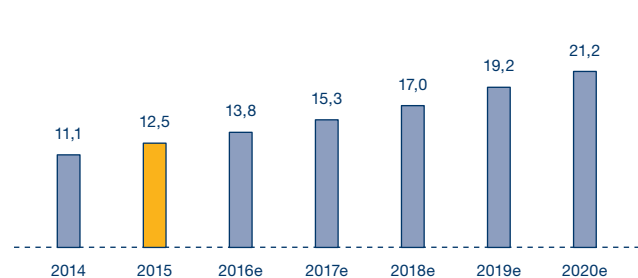
Erwartete Entwicklung in den Hauptmärkten

MIKROSYSTEMTECHNIK (MEMS)

Der Markt für Mikroelektromechanische Systeme entwickelt sich weiterhin sehr dynamisch. Den Schätzungen des Marktforschungsinstitutes Yole Développement zu Folge hatte der MEMS-Markt im Jahr 2000 ein Volumen von rund 5 Mrd. USD. Im Jahr 2014 waren es bereits 11,1 Mrd. USD und Yole erwartet für 2020 ein Marktvolumen von über 20 Mrd. USD. Das Stückzahlenwachstum der einzelnen MEMS-Bausteine ist bedeutend höher, durch Preisdruck und neue Designs wächst das Marktvolumen allerdings langsamer als die Stückzahlen. Für die Equipment-Branche ist zudem zu berücksichtigen, dass durch Effizienzgewinne, Durchsatz- und Yield-Erhöhungen sowie durch den Trend zu größeren Wafer-Durchmessern das Wachstum im Maschinenbereich erheblich geringer ausfallen wird. Yole erwartet in seinen Schätzungen vom Juni 2015 nur für den Bereich Lithografiemaschinen ein durchschnittliches jährliches Umsatzwachstum 7 % (CAGR) bis zum Jahr 2020. Neben Lithografiegeräten kommen bei der MEMS-Herstellung auch Bonder von SÜSS MicroTec zum Einsatz. Aus diesem Grund wird der MEMS-Markt auch in Zukunft ein sehr attraktives Geschäftsfeld für SÜSS MicroTec sein.

Bei einem genaueren Blick auf die einzelnen Arten von MEMS-Sensoren wird deutlich, dass der Bereich Konsumelektronik mit einem Volumen von rund 6,4 Mrd. USD schon heute den mit Abstand größten Anwendungsbereich darstellt und zudem zukünftig das größte Wachstum aufweisen wird. Der Anteil am gesamten MEMS-Markt lag 2015 bereits bei über 50%. Getrieben wird diese Entwicklung durch das Internet of Things, die rapide zunehmende Vernetzung sowie die damit einhergehende Verbreitung von tragbarer Elektronik in Form von Uhren oder Armbändern. Der zweitstärkste Wachstumsbereich wird nach

Markt für MEMS in Mrd. USD



Quelle: Yole, Mai 2015

Erwartungen von Yole Développement die Medizintechnik sein. Ausgehend von einem bislang geringen Marktvolumen von rund 700 Mio. USD, werden auch hier zweistellige jährliche Wachstumsraten bis 2020 erwartet.

ADVANCED PACKAGING UND 3D-INTEGRATION

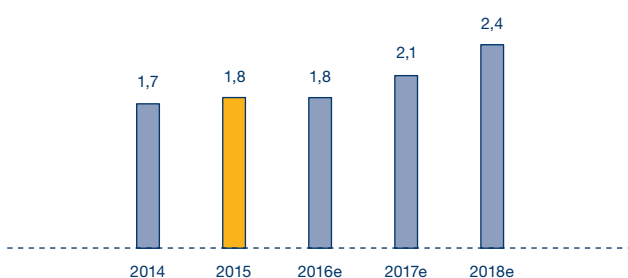
Unter dem Begriff Advanced Packaging subsummiert man heute verschiedene Technologien, wie beispielsweise das Wafer-Level Packaging (WLP), wo die jeweilige Kontaktierung bereits stattfindet, während die einzelnen Chips sich noch auf dem Wafer befinden. Dazu gibt es die Unterformen Fan-in und Fan-out WLP, Flip Chip-Bonding, Wafer-Level Chip-Scale Packaging sowie die 2,5D-Integration und die 3D-Integration. SÜSS MicroTec ist insbesondere mit seinen Lithografie- und Temporary Bonding-Lösungen in diesem Feld aktiv.

Laut einer Analyse des Marktforschungsinstituts Gartner (Januar 2016) ist der Markt für Wafer-Level Packaging und Assembly Equipment im Jahr 2015 um 4,4% auf rund 1,8 Mrd. USD gewachsen (Vorjahr plus 14,3%). In einer älteren Studie vom Juli 2015 erwartete Gartner für 2015 noch ein Wachstum in Höhe von 5,3%. Nach aktuellsten Schätzungen vom Januar 2016 wird dieser Bereich im Jahr 2016 leicht um 0,1% schrumpfen, um dann 2017 mit einem kräftigen Wachstum von 14,6% auf den positiven Wachstumspfad zurückzukehren. Laut Marktforschungsinstitut Yole Développement werden insbesondere Maschinenbauer aus dem Bereich Lithografie für Applikationen und Endanwendungen wie MEMS, Advanced Packaging und LED von diesem Trend profitieren. SÜSS MicroTec hat bereits 2015 mit seinen Lithografie-Lösungen für moderne Fan-out WLP-Anwendungen wichtige, großvolumige Aufträge verbuchen können.

Die 3D-Integration ist die weiterentwickelte Form der heute eingesetzten Advanced Packaging-Technologien, hierbei werden gedünnte Mikrochips übereinander gestapelt und durch TSVs (Thru Silicon Vias) miteinander verbunden. Die Vorteile sind eine große Packungsdichte und eine hohe Komplexität, die auf kleinstem Raum erreicht werden kann. Durch die 3D-Integration ist es zudem möglich, verschiedene Funktionalitäten, wie beispielsweise Speicher und Prozessor, in einem Package zu vereinigen.

Im Prognosebericht des Geschäftsberichts 2014 haben wir geschrieben, dass gemäß den Erwartungen des Marktforschungsinstituts Yole das Jahr 2015 eine besondere Bedeutung haben könnte. Nachdem im Jahr 2014 verschiedene Speicherchiphersteller den Einstieg in die Vorserienproduktion bzw. die Produktion von Prototypen bekannt gegeben hatten, wurden für 2015 erste Aufträge für den Übergang zur Volumenproduktion erwartet. Zurückblickend stellen wir fest, dass im Geschäftsjahr 2015 weiterhin nennenswerte Investitionen in diese Technologie getätigt wurden, aber der Einstieg in die Großserienproduktion bei keinem Unternehmen stattgefunden hat. SÜSS MicroTec ist dennoch zuversichtlich, dass diese Technologie zukünftig zum Umsatz- und Ergebniswachstum des Unternehmens beitragen wird. Allerdings ist es aufgrund der bisherigen Verzögerung aus heutiger Sicht extrem schwer, den zeitlichen Aspekt näher zu benennen. In der Zwischenzeit profitiert das Unternehmen von anderen neuartigen Packaging-Technologien, die bereits in nennenswertem Volumen zum Einsatz kommen laufen und zudem großes Potenzial haben, wie beispielsweise 2,5D oder Fan-out WLP oder Copper-pillar Bumping.

Markt für Wafer-Level Packaging und Assembly Equipment in Mrd. USD



Quelle: Gartner, Januar 2016

VERBINDUNGSHALBLEITER (LED)

Der Markt für Verbindungshalbleiter spielt für SÜSS MicroTec eine eher untergeordnete Rolle. Nur die Jahre 2010 und 2011 haben hierbei eine Ausnahme dargestellt. 2015 lag der Anteil am Gesamtumsatz erneut deutlich unter 10 % und aus heutiger Sicht ist ein Anstieg dieses Anteils nicht abzusehen. Die LED-Industrie wird zukünftig nicht mehr primär durch den Verkauf einzelnen LEDs für Bildschirme geprägt sein, sondern der Trend geht zu ganzen Lichtmodulen für die generelle Beleuchtung. Hier erwartet Yole Développement einen Anstieg des Marktvolumens von rund 3 Mrd. USD im Jahr 2015 auf bis zu 10 Mrd. USD bis 2020.

Endogene Indikatoren

Neben der Entwicklung in den Zielmärkten ist für den Geschäftserfolg das Innovationspotenzial entscheidend. SÜSS MicroTec ist auch im Geschäftsjahr 2015 wichtige Entwicklungskooperationen mit namhaften Partnern aus Industrie und Forschung eingegangen. Kooperationen mit renommierten Universitäten und Forschungsinstituten sowie technologiegetriebenen Unternehmen sind ein wichtiger Bestandteil unserer Unternehmensstrategie.

Im Januar 2015 hat SÜSS MicroTec die Zusammenarbeit mit Nuflare Technology, einem japanischen Equipment-Hersteller, begonnen. Mit dieser Zusammenarbeit stärkt das Unternehmen gezielt das Segment Fotomasken Equipment. In diesem Bereich hat Nuflare eine sehr gute Marktposition und man wird gemeinsam an zukunftssträchtigen Technologien und neuen Prozesslösungen im Bereich Fotomasken Equipment arbeiten. Darüber hinaus wurde im ersten Halbjahr 2015 eine Kooperation mit dem Georgia Institute of Technology (Georgia Tech) begonnen. Georgia Tech wird mit uns insbesondere auf den Gebieten Nanotechnologie, bio-medizinische Anwendungen und Halbleiter-Packaging (3D) zusammenarbeiten. Seit Jahresanfang 2015 ist SÜSS MicroTec zudem Mitglied in Georgia Tech's Packaging Research Center (PRC). Dort werden fortschrittliche Belichtungssysteme, wie beispielsweise Excimer Laser-Ablationssysteme zum Via-drilling auf nicht-fotosensitiven Materialien eingesetzt und erforscht.

Im August 2015 haben SÜSS MicroTec und das Singh Center für Nanotechnologie der Universität von Pennsylvania (Penn) eine Zusammenarbeit im Bereich der Nanoimprinting-Technologien angekündigt. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit hat Penn Maschinen und das technologische Know-how für das SCIL-Verfahren (Substrate Conformal Imprint Lithography) erhalten, das die Leistungsfähigkeit des bereits an der Penn installierten Mask Aligner MA/BA6 Gen3 deutlich erweitern. Bei der SCIL-Technologie handelt es sich um ein Nanoimprinting-Verfahren,

das die Vorteile der weichen und starren Stempel vereint und so die Reproduzierung großflächiger Strukturen bei einer Auflösung von unter 50 nm ermöglicht. SCIL kommt in vielfältigen Bereichen zum Einsatz, von HB-LEDs und Photovoltaik über MEMS und NEMS bis hin zur Massenproduktion von optischen Gittern für die Gassensorik und die Telekommunikation.

Gesamtaussage zur voraussichtlichen Entwicklung des Konzerns – Ausblick 2016

Aufgrund des Auftragsbestands zum Jahresende 2015 und der erwarteten Auftragseingangsentwicklung für das erste Halbjahr 2016 prognostiziert das Unternehmen einen Umsatz für das laufende Geschäftsjahr in der Bandbreite zwischen 170 und 180 Mio. € sowie ein positives Ergebnis (EBIT) zwischen 9 und 13 Mio. €.

In einem von kurzfristigen Kundenentscheidungen geprägten Marktumfeld gehen wir für das erste Halbjahr 2016 von einer moderaten Auftragseingangsentwicklung aus. Für das zweite Halbjahr 2016 erwarten wir eine Belebung der Nachfrage nach unseren Produkten und Lösungen, werden jedoch im Gesamtjahr 2016 voraussichtlich einen Auftragseingang unter dem Niveau des Vorjahres ausweisen. Für das Geschäftsjahr 2016 streben wir zudem einen ausgeglichenen Cashflow an.

Nach einem extrem starken vierten Quartal 2015 wird für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2016 ein Auftragseingang in Höhe von 25 bis 35 Mio. € erwartet.

Das Segment Lithografie wird im Geschäftsjahr 2016 erneut den größten Umsatz- und Ergebnisbeitrag für den Konzern liefern. Auf Basis des zum Jahresende 2015 gebuchten Auftragsbestands und der Auftragseingangserwartung für das erste Quartal 2016, rechnen wir gegenüber 2015 mit einem deutlich erhöhten Umsatz und EBIT. Letzteres wird im Bereich 14 bis 17 Mio. € erwartet. Für das Segment Substrat Bonder erwarten wir einen Umsatzanstieg und ein gegenüber dem Vorjahr leicht verbessertes aber dennoch negatives EBIT im niedrigen einstelligen Millionenbereich. Die Umsätze und das EBIT des Segments Fotomasken Equipment werden im kommenden Jahr erwartungsgemäß auf einem ähnlichen Niveau wie im Vorjahr liegen. Am Ziel, das organische Wachstum unseres Basisgeschäfts ohne zusätzliche Fremdmittel bestreiten zu können, halten wir weiterhin fest.

Zukunftsgerichtete Angaben

Dieser Bericht enthält Angaben und Prognosen, die sich auf zukünftige Entwicklungen des SÜSS MicroTec-Konzerns und seiner Gesellschaften beziehen. Die Prognosen stellen Einschätzungen dar, die wir auf Basis aller uns zum derzeitigen Zeitpunkt zur Verfügung stehenden Informationen getroffen haben. Sollten die den Prognosen zu Grunde gelegten Annahmen nicht eintreffen oder Risiken – wie die im Risikobericht angesprochenen – eintreten, so können die tatsächlichen Ergebnisse von den derzeit erwarteten Ergebnissen abweichen.

Garching, 9. März 2016



Dr. Per-Ove Hansson
Vorstandsvorsitzender



Michael Knopp
Finanzvorstand



Walter Braun
Produktionsvorstand